

ผลของการแทนที่ไอออนในตำแหน่ง B ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติกักเก็บ พลังงานในเซรามิกเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน NaNbO3- Bi(Li, B")O3



วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลของการแทนที่ไอออนในตำแหน่ง B ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติกักเก็บ พลังงานในเซรามิกเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน NaNbO3- Bi(Li, B")O3



วิทยานิพนธ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลของการแทนที่ไอออนในตำแหน่ง B ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติกัก เก็บพลังงานในเซรามิกเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน NaNbO3- Bi(Li, B")O3" ของ พาทิศ เปรมวิชิต ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอำนรรค)	ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจา <mark>รย์</mark> ดร.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร)	ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ จุติมูสิก)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
	อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

PAGE 4

ชื่อเรื่อง	ผลของการแทนที่ไอออนในตำแหน่ง B ที่มีต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และ
	สมบัติกักเก็บพลังงานในเซรามิกเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน NaNbO3-
	Bi(Li, B″)O ₃
ผู้วิจัย	พาทิศ เปรมวิชิต
ประธานที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร
ประเภทสารนิพนธ์	วิทยานิพนธ์ วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2566
คำสำคัญ	เซรามิกไร้สารตะกั่ว, NaNbO3, คุณสมบัติการกักเก็บพลังงาน

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปแล้ว เซรามิก NaNbO₃ (NN) ถือเป็นหนึ่งในวัสดุเพอรอฟสไกต์ที่ไร้สารตะกั่ว (AFE) ที่มีแนวโน้มที่ดี เนื่องมาจากมีข้อได้เปรียบด้านราคาต้นทุนต่ำ มีความหนาแน่นต่ำ และไม่เป็น พิษ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการกักเก็บพลังงานของวัสดุนี้มักถูกจำกัด เนื่องมาจากวงวนฮิส เทอรีซิสขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกไปเป็นเฟสเฟร์โรอิเล็กทริก ใน การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาผลของการเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนในเซรามิก NaNbO₃ ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติ การนำไฟฟ้า และความเสถียรต่ออุณหภูมิ โดยเตรียมผงผลึกและเซรามิกกลุ่ม (1-x)NaNbO₃xBi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ ด้วยวิธีปฏิกิริยายาสถานะของแข็ง โดยใช้อุณ ภูมิแคลไซน์ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และอุณภูมิชินเตอร์ระหว่าง 1315-1250 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

สำหรับเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ ที่ปริมาณ x = 0-0.10 จากการ วิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ พบว่าเซรามิกแสดงโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ ที่มีความบริสุทธิ์ที่ปริมาณ $0 \le x \le 0.08$ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากออร์โธรอมบิกไปเป็น โครงสร้างซูโดคิวบิกที่ปริมาณ x = 0.06 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แสดงลักษณะเกรนที่มี ความหนาแน่น โดยขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงจาก 7.05 µm (สำหรับ x = 0) เป็น 0.78 µm (สำหรับ x = 0.04) ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเพิ่มปริมาณ Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ สมบัติไดอิเล็กทริก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกจากเฟส *P* ไปเป็นเฟส *R* อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ วงฮีสเทอรีซีส *P-E* มีลักษณะแบบบาง นำไปสู่การปรับปรุงสมบัติการกักเก็บพลังงาน ซึ่งค่าความ หนาแน่นการกักเก็บพลังงาน (W_{rec}) และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (**ヿ**) เพิ่มขึ้นตามปริมาณ การเติม Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงสุดที่ปริมาณ x = 0.06 ($W_{rec} = 0.56$ J/cm³, **ヿ** = 74%) ภายใต้สนามไฟฟ้า 120 kV/cm และที่ปริมาณ x = 0.06 ยังแสดงความเสถียรของอุณหภูมิใน ช่วงกว้าง (25–100 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณ Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ ส่งผลให้ค่า ความหนาแน่นกระแสรั่วไหลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับเซรามิก (1-x)NaNbO3-xBi(Li1/3Hf2/3)O3 ที่ปริมาณ x = 0-0.10 จากการ วิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์พบว่าเซรามิกแสดงโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ ์ ที่มีความบริสุทธิ์ที่ปริมาณ 0 ≤ x ≤ 0.10 และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากออร์โธรอมบิกไปเป็น ์ โครงสร้างซูโดคิวบิกที่ปริมาณ x = 0.04 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แสดงลักษณะเกรนที่มี ความหนาแน่น โดยขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงจาก 7.05 µm (สำหรับ x = 0) เป็น 0.96 µm ้ (สำหรับ x = 0.08) ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้<mark>อย เ</mark>มื่อเพิ่มปริมาณ Bi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ สมบัติไดอิเล็กทริก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนของเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกจากเฟส P ไปเป็นเฟส R อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ้สอดคล้องกับข้อมูลรา<mark>มาน</mark>สเปกโทรสโกปี ด้วยความเป็นรีแลก<mark>เซอร์</mark>ไดอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้น ขนาดเกรน ้ที่เล็กลง ค่าสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ต่ำ และค่าความ<mark>หนา</mark>แน่นกระแสรั่วไหลลดลง นำไปสู่การปรับปรุงค่า ้สนามไฟฟ้าเบร<mark>กด</mark>าวน์ (E_b) ส่งผลให้เซรามิก xBLH มีค่าความหน<mark>าแน่</mark>นการกักเก็บพลังงานที่สูง (W_{rec}= 0.85 J/cm³) และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานที่ดี (**ท**= 78%) ภายใต้สนามไฟฟ้า 165 kV/cm (สำหรับ x = 0.08) และที่ปริมาณ x = 0.08 ยังแสดงความเส<mark>ถียร</mark>ของอุณหภูมิในช่วงกว้าง (25–150 <mark>องศาเซลเซียส) น</mark>อกจากนี้ ผลการวิเคราะห์สมบัติก<mark>ารนำไฟฟ้าโดยเทค</mark>นิคอิมพีแดนซ์สเปก ้ โทรสโคปี <mark>แสดงให้เห็นถึงโครง</mark>สร้างจุลภาคเชิงไฟฟ้าที่มี<mark>ความเป็นเนื้อเดี</mark>ยวกั<mark>นมากขึ้นเมื่อเติมด้วย</mark> BLH และค่าสภาพต้านทาน (ho) ที่อุณหภูมิสูง (540°C) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 6.72×10⁵ Ω .m (สำหรับ x = 0) เป็น $1.31 \times 10^6 \ \Omega$.m ที่ปริมาณ x = 0.08 พร้อมด้วยค่าพลังงานกระตุ้น (E_a) ที่มีค่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเซรามิก NaNbO3 บริสุทธิ์

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาและผลิตเซรามิกไร้ตะกั่วที่มี ความ หนาแน่นการกักเก็บพลังงานและประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้เป็น ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ต่อไป PAGE 4

Title	EFFECTS OF B-SITE SUBSTITUTION ON THE DIELECTRIC AND
	ENERGY-STORAGE PROPERTIES OF COMPLEX PEROVSKITE
	NANBO3- BI(LI, B")O3CERAMICS
Author	Pathit Premwichit
Advisor	Assistant Professor Sasipohn Prasertpalichat, Ph.D.
Academic Paper	M.S. Thesis in Applied Physics, Naresuan University, 2023
Keywords	Lead-free ceramics, NaNbO3, Energy storage properties

ABSTRACT

In general, NaNbO₃ (NN) ceramics are considered to be one of the most promising lead-free perovskites (AFE) materials with low cost, low density, and non-toxic advantages. However, the energy storage capability of this material is often greatly hindered by the hysteresis exhibited during the transition from the antiferroelectric to the ferroelectric phase. In this study, the effects of doping with B-site complex perovskite compound in NaNbO₃ ceramics on the crystal structure, microstructure, energy storage properties, electrical conductivity, and temperature stability were investigated. The crystalline powder and ceramic of (1-*x*)NaNbO₃-*x*Bi(Li_{1/3}Sh_{2/3})O₃ and (1-*x*)NaNbO₃-*x*Bi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ were prepared using a conventional solid-state reaction method. The powder mixtures were calcined at 900°C for 5 hours in the air, and the pellets were sintered at 1225°C-1315°C for 2 hours in a closed alumina crucible.

For lead-free (1-*x*)NaNbO₃-*x*Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ (x = 0-0.10) dielectric ceramics, the XRD data showed a pure perovskite structure for $0 \le x \le 0.08$ compositions and structural change from orthorhombic to pseudo-cubic for x = 0.06 composition. The average grain size decreased from 7.05 µm (x = 0) to 0.78 µm (x = 0.04) before experiencing a slight increase at x^3 0.06 compositions. With increasing Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ content, changes in dielectric properties demonstrated that the AFE *P* phase was successively replaced by the relaxor AFE *R* phase, resulting in a thin *P–E* loop characteristic which leads to the improvement of the energy storage density and efficiency of the ceramic capacitors. The optimum recoverable energy storage density $(W_{\rm rec} = 0.56 \text{ J/cm}^3)$ and efficiency ($\eta = 74$ %) were obtained at x = 0.06 under an electric field of 120 kV/cm. The optimum composition also exhibited temperature stability in the range of 25°C–100°C. In addition, an increase in Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O₃ content can lead to a decrease in leakage current density.

For lead-free (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ (x = 0-0.12) dielectric ceramics, the XRD data showed a pure perovskite structure for $0 \le x \le 0.10$ compositions and structural change from orthorhombic to pseudo-cubic at x = 0.04 composition. The average grain size decreased from 7.05 μ m (x = 0) to 0.96 μ m (x = 0.08) before experiencing a slight increase. With increasing Bi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ content, changes in dielectric properties demonstrated that the AFE P phase was successively replaced by the relaxor AFE R phase, which is consistent with the Raman spectroscopic data. Increased dielectric relaxation, smaller grain size, low dielectric loss, and reduced leakage current density lead to an improvement in the electric breakdown strength $(E_{\rm b})$, resulting in a high energy storage density ($W_{\rm rec}$ = 0.85 J/cm³) and energy storage efficiency ($\eta = 78\%$) under an electric field of 165 kV/cm (for x = 0.08). The optimum composition also exhibited temperature stability in the range of 25°C-150°C. With an increase in the $Bi(Li_{1/3}Sn_{2/3})O_3$ content, a decrease in leakage current density was also observed. With increasing BLH, the impedance spectroscopy data revealed more electrically homogeneous microstructure with a significant increase in resistivity (ρ) from 6.72×10⁵ Ω .m (for x = 0) to 1.31×10⁶ Ω .m at x = 0.08. For the activation energy (E_{a}) , the values increased to 1.42 and 1.17 eV for x = 0.04 and 0.08, respectively.

This research provides a guideline for the development and manufacture of lead-free ceramics with energy storage density and energy storage efficiency that is suitable for applications in electronic devices or energy-storage technology.

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากความร่วมมือการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการและด้านดำเนินงานวิจัย จากบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นเรศวร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาให้คำแนะนำปรึกษา ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตรวจแก้ไขผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติและวิทยานิพนธ์เล่มนี้ที่เป็นประโยชน์ทำให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ตรีอำนรรค ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ จุติมูสิก กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่ก<mark>รุณ</mark>าให้คำแนะนำ แก้ไขและตรวจสอบวิทยานิพนธ์จนทำให้การศึกษาครั้งนี้ สมบูรณ์

ขอขอ<mark>บคุณ</mark> ดร.นพดล นั่นทวงศ์ หัวหน้าทีมจิวัยเทคโนโล<mark>ยีเ</mark>ซ็นเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์<mark>แห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุ</mark>นอุปกรณ์เครื่องมือวัด วิเคราะห์โครงสร<mark>้างโ</mark>ดยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด แคน อาจารย์วิ<mark>ศวกรรมเครื่องกล</mark> อุตสาหการ และการ ผลิต มหาวิทยาลั<mark>ยแห่งรัฐโอริก</mark>อน และคุณเกศแก้ว บุญแปง ในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัดสมบัติ เฟร์โรอิเล็กทริกทดสอบชิ้นงาน และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณ ดร. อรธิดา โกษาแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัดสมบัติการนำไฟฟ้าในเซรามิกโดยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี

ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวัดสมบัติเฟร์โรอิ เล็กทริกทดสอบชิ้นงาน

ขอขอบพระคุณภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อำนวยความสะดวกในด้าน ห้องปฏิบัติการ ทุนสนับสนุนบางส่วนในการศึกษาวิทยานิพนธ์

ท้ายสุด หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูง ข้าพเจ้าหวังว่างานวิจัยนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ต้องการศึกษาต่อไป

สารบัญ

หน้	้ำ
บทคัดย่อภาษาไทยค	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษจ	
ประกาศคุณูปการช	
สารบัญซ	
สารบัญตารางฏ	
สารบัญรูปภาพฐ	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 คว <mark>า</mark> มเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	
1.2 จุด <mark>มุ่งหมายของการวิจัย4</mark>	
1.3 ขอบเขตการวิจัย	
1.4 สมมุติฐานของการวิจัย	
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (energy-storage technology)6	
2.2 ความหนาแน่นพลังงานของวัสดุไดอิเล็กทริก (energy density)	
2.3 ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (electrical breakdown strength: Eb)	
2.4 โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ (perovskite structure)12	
2.5 สมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric property)14	
2.6 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray diffractometer)16	
2.7 ความหนาแน่น (density)20	

2.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM)	
2	1
2.9 รามานสเปกโตสโคปี (raman spectroscopy)2	3
2.10 เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีสำหรับเซรามิกไฟฟ้า (Impedance	
spectroscopy)2	4
2.11 กระบวนการเตรียมแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง2	7
2.12 กระบวนการบดย่อยผสมด้วยลูกบอล2	8
2.13 การแคลไซน์ (calcination)2	9
2.14 การซินเตอร์ (sintering)3	0
2.15 การทบ <mark>ทว</mark> นวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง	2
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	9
3.1 สา <mark>ร</mark> เคมีที่ใช้ในการทุดลอง3	9
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมสาร	9
3.3 วิธีทำการทดลอง	0
3.4 การเตรียมชิ้นงานเซราม <mark>ิก สำหรับวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ</mark> และสมบัติต่าง ๆ4	6
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล	0
4.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติกายภาพและสมบัติไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)NaNbO ₃ -xBi(Li _{1/3}	3,
Sn _{2/3})O ₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง5	0
4.1.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray	
diffraction: XRD) ของเซรามิก <i>x</i> BLS5	0
4.1.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง	
กราด (Scanning electron microscope: SEM) ของเซรามิก xBLS5	1
4.1.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก xBLS5	2

สารบัญตาราง

٩	หน้า
ตาราง 1 ไอออนบวกของธาตุที่ตำแหน่ง A B´ และ B´´ ที่เป็นไปได้ พร้อมตัวอย่าง	
โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง B [26]1	13
ตาราง 2 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนเฟส (T _{P-R}) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : E r) ค่า	
ไดอิเล็กทริกสูงสุด (dielectric maxima: ɛ ุุุ) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric	
loss : tanδ) ที่ความถี่ 1 kHz ของเซรามิก xBLS (x = 0-0.08)5	54
ตาราง 3 พารามิเตอร์ <mark>ที่เกี่ย</mark> วข้องกับสมบัติการเก็บพลังงานของเซรามิก xBLS (x = 0—0.08	8)
	57
ตาราง 4 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนเฟส (T _{P-R}) ค่าคงที่ได _้ อิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}_r) ค่า	
ไดอิเล็กทริกสูง <mark>สุด</mark> (dielectric maxima: E _m) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric	
loss : tanδ) ที่ความถี่ 1 kHz ของเซรามิก xBLH (x = 0–0.10)	54
ตาราง 5 <mark>พารามิเตอร์ที่เกี่ยว</mark> ข้องกับสมบัติการเก็บพลังง <mark>านขอ</mark> งเซ <mark>ร</mark> ามิก xBLH (x = 0—0.1	0)
	58
ตาราง 6 ค่าสภาพคว <mark>ามต้านทาน (ρ) ณ อุณหภูมิ 460</mark> , <mark>480</mark> , 500, 520 และ 540 องศา	
เซลเซียส และค่าพลังงานกระตุ้น (E _a) ของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10)7	73

สารบัญรูปภาพ

ภาพ 1 กราฟเปรียบเทียบความหนาแน่นกำลังงาน (Power density) และความหนาแน่น	
พลังงาน (Energy density) ของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ [20]7	7
ภาพ 2 วงวนฮิสเทอรีซิสและค่าความหนาแน่นของการกักเก็บพลังงาน (W _{rec}) พร้อมกับค่า ความสูญเสียความหนาแน่นพลังงาน (W _{toss}) ของวัสดุไดอิเล็กทริกทั้ง 4 ประเภทได้แก่ (ก) ไดอิเล็กทริกเชิงเส้น (LD), (ข) เฟร์โรอิเล <mark>็กทริก (FE), (ค) รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริก (RFE)</mark> และ (ง) แอนติเฟร์โรอิเล็ก <mark>ทริก (AFE) [21]</mark>	•
ภาพ 3 ไดอ <mark>ะ</mark> แกรมแส <mark>ด</mark> งความหนาแน่นพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ (W _{rec}) และค่าการ	
สูญเสียความหน <mark>าแน่</mark> นพลังงาน (W _{Loss}) จากวงวนฮิสเทอรีซิส [2 <mark>2]</mark>)
ภาพ 4 โครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ (ABO3) [25]	2
ภาพ 5 แสดงโครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่มีไอออนที่ตำแหน่ง A และ B หลายชนิด	
	3
ภาพ 6 ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน [27]	1
ภาพ 7 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกก์	3
ภาพ 8 การกระเจิงของแสงแบบต่างๆ เมื่อชนโมเลกุลของสาร [32]23	3
ภาพ 9 แผนภาพเปรียบเทียบการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในปรากฏการณ์ต่าง	3
ຳ [33]24	1
ภาพ 10 วงจรสมมูลไฟฟ้าอย่างง่ายของวัสดุไดอิเล็กทริก (ก) แบบเอกพันธ์	
(homogeneous electrical microstructure) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว (ข) แบบวิวิธพันธ์	
(heterogeneous electrical microstructure) ซึ่งมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของเกรน ขอบ	
เกรน และขั้วไฟฟ้า [35]27	7
ภาพ 11 แสดงภาพตัดขวางแสดงองค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบอล)

หน้า

ภาพ 19 (a) ความต้านทานไฟฟ้าของเซรามิก BT-xBLT (b) การกระจาย Weibull ของ E _b
ของเซรามิก BT- xBLT (c) W _{total} และ ท ของเซรามิก BT-xBLT (d) W _{total} , W _{rec} และ ท ของ
เซรามิก 0.90BT-0.10BLT ที่สนามไฟฟ้าต่างๆ38
ภาพ 20 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก (1-x)NaNbO ₃ -xBi(Li _{1/3} , Sn _{2/3})O ₃ 41
ภาพ 21 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก (1-x)NaNbO ₃ -xBi(Li _{1/3} , Hf _{2/3})O ₃ 42
ภาพ 22 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO ₃ -xBi(Li _{1/3} , Sn _{2/3})O ₃ 44
ภาพ 23 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO ₃ -xBi(Li _{1/3} , Hf _{2/3})O ₃ 45
ภาพ 24 รูปแบบการเลี้ยวเบ <mark>นรังสีเ</mark> อ็กซ์ของเซรามิก xBLS. (x = 0—0.10) ที่มุม.2 0 -โดยที่
(n).20°—80°.(v).45° <mark>—48</mark> °
ภาพ 25 (ก <mark>)–(จ) ภา</mark> พถ่ายโครงสร้างจุล <mark>ภาคของ</mark> พื้นผิวเซรามิก xBLS (x = 0–0.08) ที่ถูกกัด
ด้วยความร้อนพร้อมส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรน
ภาพ 26 (ก)–(จ) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : <i>E</i>) และค่าการสูญเสียไดอิ เล็กทริก (dielectric loss : tan <i>a</i>) ของเซรามิก <i>x</i> BLS (x = 0–0.08) ที่ไม่ได้ผ่านการโพล ในช่วงวอนของซี่ขั้นเต่ 25 (150 วาชวเซอเซียว และความอื่ 1, 10 และ 100 แม-
เนขางขุณทรูเมตงแต 25–450 องศา แซลเซอส และศารามธา 1, 10, และ 100 kHz
ภาพ 27 (ก) กราฟวงว <mark>นฮีสเทอรีซิส (P—E loop) แบบขัวเดียว</mark> (ข) ค่าโพลาไรเซชันสูงสุด
(P _{max}) และค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (P _r) และ (ค) ความหนาแน่นของการกักเก็บพลังงานที่นำ
กลับมาใช้ใหม่ได้ (W _{rec}) <mark>และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน</mark> (η) ของเซรามิก xBLS (x =
0—0.08)
ภาพ 28 (ก) วงวนฮีสเทอรีซิส <i>P-E</i> ที่ปริมาณ x = 0.06 ภายใต้สนามไฟฟ้า 80 kV/cm ในช่วง
อุณหภูมิ 25—100 องศาเซลเซียส (ข) ค่า $W_{ m rec}$ และ $oldsymbol{\eta}$ ของเซรามิก 0.06BLS ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ58
ภาพ 29 ความหนาแน่นกระแสรั่วไหลวัดที่อุณหภูมิห้องภายใต้สนามไฟฟ้า 60 kV/cm ของ
เซรามิก xBLS (x = 0—0.08)

ภาพ 30 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก xBLH. (x = 0—0.12).ที่มุม.20- (ก).
20°—80°. (v).45°—48°60
ภาพ 31 (ก)—(ฉ) ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10) ที่ถูกกัดด้วย
ความร้อนพร้อมส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรน61
ภาพ 32 (ก)–(ฉ) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : ɛ ,) และค่าการสูญเสียไดอิ
เล็กทริก (dielectric loss : tanδ) ของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10) ที่ไม่ได้ผ่านการโพล
ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 30–450 องศาเซลเซียส และความถี่ 1, 10, และ 100 kHz63
ภาพ 33 สเปกตรัมรามานที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10)65
ภาพ 34 (ก) วงวนอีสเ <mark>ทอ</mark> รีซิส (P—E loop) ภายใต้สนามไ <mark>ฟฟ้าสู</mark> งสุดของแต่ละปริมาณ × (ข)
ค่าโพลาไรเซชันสูง <mark>สุ</mark> ด (P _{max}) และค่าโพลาไรเซชั <mark>นคงค้าง (P</mark> r) แล <mark>ะ</mark> (ค) ค่าความหนาแน่น
ของการกั <mark>กเก็บพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (W_{rec}) และประสิทธิภ</mark> าพการเก็บพลังงาน (η)
ของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10)
ภาพ 35 (ก) วงวนฮีสเทอรีซิส P-E ที่ปริมาณ × = 0.08 ภายใต้สนามไฟฟ้า 90 kV/cm ที่ช่วง
อุณหภูมิ 2 <mark>5—15<mark>0 องศาเซ</mark>ลเซียส (ข) ค่า W_{rec} และ η ของเซรามิก 0.08B</mark> LH ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ
ภาพ 36 ความห <mark>นาแน่นกระแสร้วไหลวัดที่อุณหภูมิห้องภายใต้สนา</mark> มไฟฟ้า 60 kV/cm ของ
เซรามิก xBLH (x = 0—0.10)
ภาพ 37 (ก)—(ค) กราฟอิมพีแดนซ์จำนวนเชิงซ้อน (Z *) และกราฟสเปกโทรสโกปิกของ
เซรามิก xBLH (x = 0, 0.04, และ 0.08) ที่อุณหภูมิ 460-540 องศาเซลเซียส และความถี่ 20
Hz – 10 MHz72
ภาพ 38 (ก) แผนภาพ Arrhenius ของเซรามิก xBLH (x = 0, 0.04, และ 0.08) และ (ข) การ เปลี่ยนแปลงของค่า E _a เมื่อปริมาณ xBLH เพิ่มขึ้น73

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานเนื่องจากความเจริญ ด้านอุตสาหกรรม และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการศึกษาและพัฒนา พลังงานเพื่อทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมซึ่งมีอยู่จำกัดและก่อให้เกิดมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม แม้ว่าพลังงานทางเลือกสะ<mark>อาดต่างๆ เช่น พลัง</mark>งานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานคลื่น เป็นต้น จะมีในธรรมชาติอย่างไม่จำกัด แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของความไม่ต่อเนื่อง จึง ้จำเป็นต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage system) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้กักเก็บ พลังงานไฟฟ้าส่ว<mark>นเกิ</mark>นไว้และจ่ายคืนอ<mark>อกมาในช่วงที่</mark>ไม่สามารถผลิต<mark>พลั</mark>งงานไฟฟ้าได้ โดยตัวเก็บ พลังงานที่เหมา<mark>ะ</mark>สมจะต้องมีทั้งความหนา<mark>แน่นพลังงา</mark>น (energy density) และความหนาแน่นกำลัง ้งาน (power d<mark>en</mark>sity) ที่สูง อย่างไรก็ตามพบว่าระบบกักเก็บพลัง<mark>งาน</mark>ที่ม<mark>ีอ</mark>ยู่ในปัจจุบัน เช่น แบตเตอร์รี่ เซลล์เชื้อเพ<mark>ลิง แล</mark>ะตัวเก็บประจุ เป็นต้น ยังไม่สามา<mark>รถตอ</mark>บส<mark>นอง</mark>ความต้องการดังกล่าวได้ กล่าวคือ แม้ว่าจะ<mark>แบตเตอร์รี่และเ</mark>ซลล์เชื้อเพลิงจะมีความห<mark>นาแน่น</mark>พลังงา<mark>นสูง</mark> (ความจุมาก) แต่ทว่า ึกลับมีความหนาแน่นก<mark>ำลังงานต่ำ หรือใช้เวลาในการอัดและคายประ</mark>จุ (charge-discharge) ค่อนข้าง ้นานเนื่องจากจลน์ศ<mark>าสตร์ของปฏิกิริยารีด๊อกซ์ซึ่งเป็นกลไกในกา</mark>รบรรจุพ_ิลังงานเกิดปฏิกิริยาค่อนข้าง ้ช้า ในทางตรงกันข้ามตัวเก็บประจุ (capacitor) มีความหนาแน่นกำลังงานค่อนข้างมาก แต่ยังมีความ หนาแน่นของพลังงานที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของตัวเก็บประจุซึ่งมีความหนาแน่นกำลัง งานที่สูงอยู่แล้วให้มีความหนาแน่นพลังงานเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาวัสดุไดอิเล็กทริกซึ่งเป็น ้องค์ประกอบหลักจึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานสำหรับพลังงาน ทางเลือกสะอาดประเภทต่างๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้มีการศึกษา และพัฒนาตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูงอย่างกว้างขวาง

โดยในอดีตที่ผ่านมา เลดเซอร์โคเนตไททาเนต (Pb[Zr_xTi_{1-x}]O₃ : PZT) ได้ถูกนำมาใช้เป็น องค์ประกอบหลักในวัสดุไดอิเล็กทริกสำหรับตัวเก็บประจุเซรามิกความหนาแน่นพลังงานสูงอย่าง แพร่หลาย เนื่องจากมีสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก และสมบัติไดอิเล็กทริกที่ดีเยี่ยม ณ สัดส่วนองค์ประกอบ ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อเฟสมอร์โฟทรอปิก (Morphotropic Phase Boundary : MPB) ระหว่างเฟส เททระโกนัลและรอมโบฮีดรัล เช่น Pb(Zr, Sn, Ti)O₃ (PZST) (Pb, La)(Zr, Ti)O₃ (PLZT) และ (Pb, La)ZrO₃ เป็นต้น [1–3] อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าออกไซด์ของตะกั่ว (PbO) ซึ่งเป็น องค์ประกอบหลักในสารประกอบเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สหภาพยุโรป (EU) และประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฯลฯ จึงได้ออกมาตรการจำกัดการนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตะกั่วเป็น องค์ประกอบ [4] ด้วยเหตุนี้การศึกษาจำนวนมากจึงมุ่งเน้นไปที่การสำรวจเซรามิกไดอิเล็กทริกที่ ปราศจากตะกั่ว เช่น เซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต (K_{0.5}Na_{0.5}NbO₃ : KNN) ซิลเวอร์ไนโอเบต (AgNbO₃ : AN) โซเดียมไนโอเบต (NaNbO₃ : NN) บิสมัทโซเดียมไททาเนต (Bi_{0.5}Na_{0.5}TiO₃, BNT) และแบเรียมไททาเนต (BaTiO₃, BT) [5] ที่มีความหนาแน่นการกักเก็บพลังงาน (*W*_{rec}) และ ประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (**1**) สูง รวมถึงมีความเสถียรทางความร้อนที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังไม่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญใดๆ เกี่ยวกับสมบัติการกักเก็บพลังงานในเซรามิกไดอิ เล็กทริก โดยทฤษฎีแล้ว ความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงาน และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน ของตัวเก็บประจุเซรามิกสามารถคำนวณได้โดยใช้สมการ 1-3 [6–8]

$$W = \int_{P_{max}}^{P_{max}} EdP$$
(1)
$$W_{rec} = \int_{P_{r}}^{P_{max}} EdP$$
(2)

$$\eta = \frac{W_{\text{rec}}}{W}$$
(3)

เมื่อ *P*_r คือค่าโพลาไรเซชันคงค้าง *P*_{max} คือค่าโพลาไรเซชันสูงสุด และ *E* คือค่าสนามไฟฟ้า จากสมการที่ 1-3 จะสังเกตได้ว่าการพัฒนาตัวเก็บประจุเซรามิกให้มีทั้งความหนาแน่นในการกักเก็บ พลังงาน และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานสูง วัสดุไดอิเล็กทริกจะต้องมีค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (P_{max}) ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (breakdown electric field : E_b) ที่สูง และมีค่าโพลาไรเซชันคง ค้าง (P_r) ที่ต่ำ [9]

ปัจจุบันวัสดุไดอิเล็กทริกที่มีอยู่สามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ไดอิเล็กทริกเซิงเส้น (linear dielectrics) เฟร์โรอิเล็กทริก (ferroelectrics) รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริก (relaxor ferroelectrics) และแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (antiferroelectric) ในบรรดาเซรามิกไดอิเล็กทริกทั้งสี ประเภทนี้ รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริก และแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกมีแนวโน้มที่จะสามารถนำมาพัฒนา เป็นตัวเก็บประจุความหนาแน่นพลังงานสูงสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมีค่า สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์และค่าโพลาไรเซชันสูงสุดที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีค่าโพลาไรเซชันคงค้างที่ต่ำ [5,10–13] ตัวอย่างเช่น Liu และคณะ [14] ได้ทำการวิจัยเซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (Pb_{0.98}xLa0.02Sr_x)(Zr_{0.9}Sn_{0.1})_{0.99}5O₃ ที่เตรียมโดยใช้กระบวนการเทปคาสติ้ง (tape-casting) ผล การศึกษาพบว่าเซรามิกมีความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงานสูงถึง 11.18 J/cm³ และล่าสุดใน งานวิจัยเซรามิกตะกั่ว 0.9PbHfO₃=0.1Pb(Mg_{0.5}W_{0.5})O₃ ที่สังเคราะหโดยกระบวนการซินเตอร์แบบมี เฟสของเหลว (liquid phase sintering) พบว่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานและประสิทธิภาพ การกักเก็บพลังงานมีค่าสูงถึง 3.7 J/cm³ และ 72.5% ตามลำดับ [15] อย่างไรก็ตาม เซรามิกไฟฟ้า แอนติเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีสมบัติกักเก็บพลังงานที่ดีเยี่ยมเหล่านี้มีองค์ประกอบหลักของสารตะกั่ว ซึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรงดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

เมื่อเร็วๆ นี้ เซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกไร้ตะกั่วโซเดียมในโอเบต (NaNbO₃) ได้รับความ สนใจเป็นอย่างมากสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุความหนาแน่นพลังงานสูง เนื่องจากการ ค้นพบสมบัติการกักเก็บพลังงานที่ดีเยี่ยมในเซรามิก NaNbO₃ ที่เติม Bi₂O₃ (*W*_{rec} = 4.03 J/cm³ และ **η** = 85.4% ที่ *E* = 250 kV/cm) [9] จากนั้นจึงมีการวิจัยอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการพัฒนา สมบัติการกักเก็บพลังงานของ NaNbO₃ โดยการเติมสารประกอบที่มีบิสมัทเป็นองค์ประกอบกลุ่ม อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบเพอรอฟสไกต์กลุ่ม Bi ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อน [B-site complex perovskite: Bi(B´, B´´)O₃] [16] เช่น Ye และคณะ [17] ได้ทำการศึกษาผลการเติม Bi(Mg_{2/3}Nb_{1/3})O₃ (BMN) ในระบบ NaNbO₃ ที่ปริมาณ 5–20 โมลเปอร์เซ็นต์ ซึ่งในภาพรวมพบว่า การเติม BMN สามารถยับยั้งการสูญเสียฮิสเทอรีซิสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เซรามิกมีสมบัติ การกักเก็บพลังงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยที่ปริมาณ BMN 10 โมลเปอร์เซ็นต์ (NN–0.10BMN) เซรา มิกมีความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานสูงสูด 2.8 J/cm³ (ภายใต้สนามไฟฟ้า 300 kV/cm) และมี ประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน 82% เมื่อปริมาณ BMN เพิ่มขึ้นเป็น 15 โมลเปอร์เซ็นต์ (NN– 0.15BMN) พบว่าเซรามิกมีค่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานลดลงเล็กน้อยเป็น 2.4 J/cm³ แต่ ทว่าความสามารถในการคายประจุมีค่าเพิ่มขึ้น ความเสถียรต่อช่วงอุณหภูมิกว้างขึ้น (20–200 องศา เซลเซียส) รวมถึงมีประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานที่ดีเยี่ยม 90% ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน นอกจากนี้ Shi และคณะ [18] ได้ศึกษาเซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (1–*x*)NaNbO₃– *x*Bi(Zn_{0.5}Zr_{0.5})O₃ และพบว่าเซรามิกที่เตรียมได้มีค่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานสูงถึง 3.14 J/cm³ โดยมีประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานเท่ากับ 84.5%

ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาผลของการเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มี โครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Li_{1/3}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และ Bi(Li_{1/3}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ในเซรามิก NaNbO₃ ซึ่งยังไม่มีการศึกษาในระบบเซรามิก NaNbO₃ มาก่อน โดยจะศึกษาอย่างเป็นระบบถึงผล ของการปรับปรุงดังกล่าวที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติ การนำไฟฟ้า และความเสถียรต่ออุณหภูมิ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีต่อ สมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก NaNbO₃ อันจะส่งผลให้สามารถออกแบบ พัฒนา และผลิต เซรามิกไร้ตะกั่วที่มีความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานและประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานที่ดีสำหรับ การประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ หรือพลังงานทางเลือกต่างๆ ต่อไป

1.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียมผงผลึกและเซรามิกของการเติม สารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และ (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

2.2 เพื่อศึกษาผลของการเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อน กลุ่ม (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และ (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ที่มีต่อ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติการนำไฟฟ้า และประสิทธิภาพใน การกักเก็บพลังงานของเซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก NaNbO₃

1.3 ขอบเขตการวิจัย

3.1 สังเคราะห์เซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/2}, Sn_{2/3})O₃ ที่ปริมาณ x= 0, 0.02, 0.04, 0.06 และ 0.08 และ (1-x)NaNbO₃-x Bi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃ ที่ปริมาณ x= 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, และ 0.10 ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งโดยใช้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และอุณหภูมิซิน เตอร์ในช่วงระหว่าง 1225 –1315 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

3.2 ตรวจสอบโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติการนำ ไฟฟ้า และประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานของเซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (1-x)NaNbO₃xBi(Li_{1/2}, Sn_{2/3})O₃ และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃

1.4 สมมุติฐานของการวิจัย

การเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Li_{1/2}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และ Bi(Li_{1/3}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ลงในเซรามิก NaNbO₃ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง สามารถปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติการนำไฟฟ้า และประสิทธิภาพในการกักเก็บ พลังงานของเซร<mark>ามิก</mark>



ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (energy-storage technology) [19]

ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมด้านการคมนาคมและขนส่งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งผลให้ความต้องการทางด้านพลังงานของโลกในปัจจุบันมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยองค์กรด้าน ข้อมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกา (Energy Information Administration: EIA) ของสหรัฐอเมริกาได้ คาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าโลกเราจะมีความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอีกถึง 56% โดย พลังงานไฟฟ้าเป็นรูปแบบของพลังงานที่มีอัตราความต้องการด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอีกถึง 56% โดย พลังงานไฟฟ้าเป็นรูปแบบของพลังงานที่มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด โดยระหว่างปี 2010 ถึง 2040 จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงปีละ 2.2% นอกจากนี้ปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหา สภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มากเกินไปได้กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พลังงาน แสงอาทิตย์ และพลังงานลม กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนและ ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพลังงานดังกล่าวจะเป็นพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่มีอย่างไม่จำกัด แต่ทว่าก็ไม่ได้มีคงที่ตลอดเวลา ดังนั้นเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (energy storage technology) ที่มี ประสิทธิภาพสูงจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการนำพลังงานเลือกเหล่านี้มาใช้งาน

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (energy storage technology) คือกระบวนการแปลงพลังงานจาก รูปแบบหนึ่ง (ส่วนใหญ่เป็นพลังงานไฟฟ้า) ไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยกักเก็บไว้ในตัวกลางต่าง ๆ ซึ่ง สามารถแปลงกลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อต้องการนำกลับมาใช้ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเก็บ พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีความไม่ต่อเนื่อง (Intermittent) โดยตัวเก็บพลังงานที่ดี นั้นจะต้องมีความหนาแน่นกำลังงาน (power density) และความหนาแน่นพลังงาน (energy density) ที่สูง อย่างไรก็ตามตัวเก็บพลังงานที่มีในปัจจุบัน (ภาพ 1) ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการนี้ได้ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) ซึ่งถึงแม้จะมีความหนาแน่นพลังงานที่ค่อนข้างสูง (200-2000 Wh/kg) แต่ทว่ากลับมีความหนาแน่นกำลังค่อนข้างต่ำ (10-100 W/kg) อันเนื่องมาจากกลไก ในการบรรจุพลังงานใช้ปฏิกิริยารีดอกซ์ซึ่งเกิดค่อนข้างข้าและนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ยากที่จะพัฒนา ให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามตัวเก็บประจุมีความหนาแน่นกำลังงานสูง (10⁴ - 10⁷ W/kg) คือรับและคายประจุได้รวดเร็ว แต่ก็มีความหนาแน่นพลังงานที่ต่ำ ดังนั้นการพัฒนาตัวเก็บประจุซึ่งมี ความหนาแน่นกำลังสูงอยู่แล้วให้มีความหนาแน่นพลังงานเพิ่มขึ้นจึงมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ใน เทคโนโลยีด้านการเก็บพลังงาน ในปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามพัฒนาตัวเก็บประจุ ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับตัวเก็บพลังงานอื่น ๆ โดยการปรับปรุงสารไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นองค์ประกอบ หลักของตัวเก็บประจุโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพัฒนาตัวเก็บประจุให้มีความหนาแน่นกำลังงานสูง และความหนาแน่นพลังงานสูง



ภาพ 1 กราฟเปรียบเทียบความหนาแน่นกำลังงาน (Power density) และความหนาแน่นพลังงาน (Energy density) ของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานชนิดต่างๆ [20]

2.2 ความหนาแน่นพลังงานของวัสดุไดอิเล็กทริก (energy density) [21]

วัสดุไดอิเล็กทริกที่ใช้ในตัวเก็บประจุสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) ไดอิเล็กทริก แบบเชิงเส้น (linear dielectrics : LD) 2) เฟร์โรอิเล็กทริก (ferroelectrics : FE) 3) รีแลกเซอร์เฟร์ โรอิเล็กทริก (relaxor ferroelectrics : RFE) และ 4) แอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (antiferroelectric : AFE) ดังแสดงในภาพ 2

สารไดอิเล็กทริกแบบเชิงเส้น (linear dielectrics : LD) ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุจำพวก โพลี เมอร์ แก้ว และเซรามิก เนื่องจากสารไดอิเล็กทริกประเภทนี้ไม่มีไดโพลโมเมนต์ถาวร จึงมีค่าคงที่ไดอิ เล็กทริก (*E*_r) คงที่ไม่ขึ้นกับสนามไฟฟ้าที่ใช้ คุณลักษณะนี้นำไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองแบบเชิงเส้น ของค่าโพลาไรเซชันภายใต้สนามไฟฟ้า ดังนั้นพลังงานที่เก็บไว้ส่วนใหญ่จึงสามารถปลดปล่อยออกมา ได้ ด้วยเหตุนี้สารไดอิเล็กทริกเชิงเส้นจึงมีประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานสูง (efficiency : *η*) นอกจากนี้ การที่ไม่มีโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นเองได้ วัสดุไดอิเล็กทริกเชิงเส้นจึงมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กท ริกและค่า *E*_r ที่ต่ำ ซึ่งนำไปสู่ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (electrical breakdown strength: *E*_b) ที่ สูง แต่อย่างไรก็ตามสารไดอิเล็กทริกเชิงเส้นมีค่า *E*_r และโพลาไรเซชันสูงสุด (maximum polarization : *P*_{max}) ที่ต่ำ ดังนั้นจึงส่งผลให้ค่าความหนาแน่นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (recoverable energy-storage density : *W*_{rec}) มีค่าไม่สูงมากนัก

สำหรับสารไดอิเล็กทริกแบบเฟร์โรอิเล็กทริก (ferroelectrics : FE) เมื่อให้สนามไฟฟ้า ภายนอก (ทิศทางบวก) จะทำให้โดเมนในผลึกพยายามจัดเรียงตัวในทิศทางตามสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป จนถึงจุดสูงสุดที่โดเมนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ปริมาณของการโพลาไรเซชันจะมีค่าสูงสุด เรียกจุด นี้ว่า $P_{\rm max}$ และเมื่อหยุดให้สนามไฟฟ้า ค่าโพลาไรเซชันจะไม่ลดลงมาจนเหลือศูนย์ เนื่องจากบาง โดเมนยังคงสภาพการโพลาไรเซชันในทิศทางเดิมอยู่ (ทิศบวก) จึงทำให้เกิดเป็นค่าโพลาไรเซชัน คงเหลือ (remnant polarization หรือ P_t) และเมื่อเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้ค่าโพลาไรเซชัน (ทิศทางลบ) จะทำให้ค่าโพลาไรเซชันลดลง และจะเรียกความเข้มสนามไฟฟ้าที่ทำให้ค่าโพลาไรเซ ชันเป็นศูนย์ว่า สนามไฟฟ้าบังคับหรือสนามไฟฟ้าลบล้าง (coercive field หรือ E_c) และเมื่อความเข้ม สนามไฟฟ้ามากกว่า E_c จะทำให้โดเมนเกิดการสลับทิศทางทำให้เกิดเป็นลักษณะของวงวนฮิสเทอรีซีส ขึ้น ซึ่งลักษณะวงวนฮีสเทอรีซีสของเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกตินั้น จะมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยม (square loop) ซึ่งมีทั้ง P_t ที่สูง และ E_c ขนาดใหญ่ จึงนำไปสู่การได้รับ $W_{\rm rec}$ และ **ท** ที่ต่ำดังแสดงในภาพ 2(ข)

สำหรับรีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริก (relaxor ferroelectrics : RFE) ได้รับความสนใจอย่าง มากสำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านการกักเก็บพลังงาน เนื่องจากมีคุณสมบัติไดอิเล็กทริก และเฟร์ โรอิเล็กทริก คล้ายคลึงกันกับวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก แต่ทว่า RFE วงวนฮีสเทอรีซิสที่แคบและเรียวบาง มากกว่า FE ทำให้มีค่า *P*, *E*, น้อยกว่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับความหนาแน่นในการกัก เก็บพลังงาน และประสิทธิภาพกักเก็บพลังงาน วัสดุ RFE มีลักษณะเฉพาะโดยมีพีคของค่าไดอิเล็กท ริกที่กว้างซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิและความถี่ ส่วนวงวนฮิสเทอรีซิสมีลักษณะที่เรียวบาง ดังแสดงในภาพ 2(ค) พฤติกรรมของ RFE นี้สันนิษฐานว่าเกิดจาก การก่อตัวของนาโนโพลาร์ (polar nanoregions : PNRs) วงวนฮิสเทอรีซิสที่เรียวบาง (*P*, ที่ต่ำ) และ *P*_{max} ที่ปานกลางของวัสดุ RFE จึงนำไปสู่ค่า *W*_{rec} ในระดับปานกลาง และ **ๅ** ที่สูง

สำหรับแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก (antiferroelectric : AFE) เป็นสารที่สามารถเกิดโพลาไรเซ ขันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับแรงกล เช่นเดียวกับสารเฟร์โรอิเล็กทริก แต่ทิศทางของโดเมนที่ตรง ข้ามและสลับกันไปทั้งผลึก ส่งผลให้ค่าโพลาไรเซชันรวมของผลึกเป็นศูนย์ สารแอนติเฟร์โรบางชนิด เมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสนามไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นสารเฟร์โรอิเล็กทริกได้ ในสนามไฟฟ้าต่ำ สารแอน ติเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีค่าโพลาไรเซชันที่ถูกเหนี่ยวนำ (induced polarizations) เป็นสัดส่วนโดยตรง กับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเกินกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (critical field, *E*_{crit}) ทำให้ ผลึกกลายเป็นเฟร์โรอิเล็กทริกและโพลาไรเซชันจะแสดงอีสเทอรีซีสที่มีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้า หากหยุดป้อนสนามไฟฟ้าดังกล่าวผลึกจะกลายเป็นสถานะแอนติโพลาร์ (anti polar state) และโพ ลาไรเซชันที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น โดยธรรมชาติของสารแอน ติเฟร์โรอิเล็กทริกจะมีวงรอบฮิสเทอรีซิส 2 วง (double hysteresis curve) โดยที่มีค่า *P*_r เกือบเป็น ศูนย์และ *P*_{max} ที่สูง ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ค่า *W*_{rec} ที่สูง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากเฟสเฟร์โรอิเล็กท ริกไปเป็นเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก ทำให้เกิดวงวนฮิสเทรีซิสขนาดใหญ่ จึงนำไปสู่ค่า **η** ในระดับ ปานกลาง ดังแสดงในภาพ 4(ง)



ภาพ 2 วงวนฮิสเทอรีซิสและค่าความหนาแน่นของการกักเก็บพลังงาน (W_{rec}) พร้อมกับค่าความ สูญเสียความหนาแน่นพลังงาน (W_{loss}) ของวัสดุไดอิเล็กทริกทั้ง 4 ประเภทได้แก่ (ก) ไดอิเล็กทริกเชิง เส้น (LD), (ข) เฟร์โรอิเล็กทริก (FE), (ค) รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริก (RFE) และ (ง) แอนติเฟร์โรอิ เล็กทริก (AFE) [21]

โดยที่สารไดอิเล็กทริกทั้งแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น (linear and nonlinear dielectrics) ค่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานรวม (total energy-storage density : W) สามารถหาได้จาก พื้นที่ใต้กราฟระหว่างแกนโพลาไรเซชัน (แกน y) กับกราฟวงวนฮิสเทอรีซิสส่วนอัดประจุ (charge) ภาพ 3 และสามารถคำนวณได้โดยตรงจากสมการ (2.1)

$$W = \int_{0}^{P_{\text{max}}} EdP \qquad (2.1)$$

เมื่อ W = ค่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานรวม

E = ค่าสนามไฟฟ้าที่ให้

P_{max} = ค่าโพลาไรเซชันสูงสุด



ภาพ 3 ไดอะแกรมแสดงความหนาแน่นพ<mark>ลังงานที่น</mark>ำกลับมาใช้ได้ (W_{rec}) และค่าการสูญเสียความ หนาแน่นพลังงาน (W_{Loss}) จากวงวนฮิสเทอรีซิส [<mark>22</mark>]

ซึ่งจากรูปจะเห็นว่าพื้นที่ภายในกราฟวงวนฮิสเทอรีซิสแสดงถึงความสูญเสียความหนาแน่น พลังงาน (W_{loss}) ดังนั้นเพื่อให้ได้รับความหนาแน่นพลังงานที่สูงเซรามิกจะต้องมีค่า P_{max} ที่สูง และมี P_r ที่ต่ำ ซึ่งจะเห็นว่าสารเฟร์โรอิเล็กทริกประเภทรีแล็กเซอร์ซึ่งมีวงวนฮิสเทอรีซิสที่แคบและบาง (มี P_m สูง มี P_r และ E_c ต่ำ) จะสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว และเนื่องมาจากความสูญเสียทาง พลังงานนี้เอง ค่าความหนาแน่นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (W_{rec}) ซึ่งคำนวณได้จากสมการ (2.2)

$$W_{rec} = \int_{P_r}^{P_{max}} EdP \qquad (2.2)$$

จึงมีค่าน้อยกว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปในตัวเก็บประจุ ดังนั้นประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (energy-storage efficiency : **η**) จึงเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับใช้พิจารณาความ เหมาะสมในการนำตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริกมาใช้ในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณ พลังงานที่กระจายหรือสูญหายไปในระหว่างกระบวนการคายประจุ (discharge) หรือภาวะกลับขั้ว (depolarization) ซึ่งแสดงค่า W_{loss} กล่าวคือ พื้นที่ภายในวงวนฮีสเทอรีซิสดังแสดงในภาพ 3 ประสิทธิภาพของการกักเก็บพลังงานของตัวเก็บประจุสามารถคำนวนได้ดังสมการที่แสดงต่อไปนี้ และ ค่า **η** สามารถคำนวณได้จากสมการ (2.3)

$$\eta = \frac{W_{rec}}{W_{rec} + W_{loss}} \times 100\%$$
(2.3)

เมื่อ W_{rec} = ความหนาแน่นพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ (recoverable energy-storage density)

W_{loss} = ค่าการสูญเสียความหนาแน่นพลังงาน

2.3 ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (electrical breakdown strength: Eb) [23]

ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ คือค่าสนามไฟฟ้าสูงสุดที่วัสดุไดอิเล็กทริกสามารถทนได้ก่อนที่จะ เกิดการซ์อต (Breakdown) หรือเสียหาย ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความเป็นฉนวนของวัสดุนั้น ค่า สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์มักถูกใช้ในการประเมินความคงทนของวัสดุต่อการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เมื่อ วัสดุไดอิเล็กทริกถูกให้สนามไฟฟ้าที่มีค่าสนามไฟฟ้าเกินกว่าค่า *E*_b หรือเมื่อให้สนามไฟฟ้าสูงเกินกว่า ค่านี้เป็นเวลานาน จะทำให้สนามไฟฟ้าในวัสดุนั้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่วัสดุไม่สามารถทนได้ จากนั้นก็จะ เกิดการซ์อต/เสียหาย ตามหลักการแล้วตัวเก็บประจุที่ทำจากวัสดุไดอิเล็กทริกเดียวกันจะมีค่า สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามไม่สามารถสังเกตได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากความ แตกต่างของคุณภาพของวัตถุ กระบวนการผลิต และความแตกต่างที่เกี่ยวข้องในคุณสมบัติของวัสดุ แต่ละชนิด

ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์หรือ *E*_b มีกระบวนการที่ซับซ้อนและกลไกต่างๆ ที่ทำงานในช่วง ของสนามไฟฟ้าและสเกลเวลาที่แตกต่างกัน สามารถนำไปสู่การเบรกดาวน์ได้ของวัสดุ ซึ่งกลไกเหล่านี้ อาจรวมไปถึงอิเล็กทรอนิกส์เบรกดาวน์ (electronic breakdown) เทอร์มอลเบรกดาวน์ (thermal breakdown) อิเล็กโตรเมคานิคอลเบรกดาวน์ (electromechanical breakdown) เป็นต้น กลไก การการเกิดการเบรกดาวน์ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง และใน บางกรณีเกิดจากกลไกสองอย่างขึ้นไป กลไกที่นำไปสู่การเบรกดาวน์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพ ของวัสดุ (ช่องว่างของแถบพลังงาน, สิ่งปนเปื้อน) สภาพการใช้งาน (อุณหภูมิ, แรงดันไฟฟ้า, ความถี่, ช่วงเวลา) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ความชื้น, ฝุ่นละออง) ซึ่งวัสดุไดอิเล็กทริกเชิงเส้นที่มีค่าสภา พยอมของสุญญากาศ (permittivity) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss) ที่ต่ำ จะ แสดงค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทเฟร์โรอิเล็กทริก นอกจากนี้ยังมี พารามิเตอร์อื่นๆ ที่มีผลต่อ E_b ของไดอิเล็กทริกอย่างมีนัยสำคัญคือ ความหนาแน่น รูพรุน ขนาดเกรน และความหนาของวัสดุ เป็นต้น

2.4 โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ (perovskite structure) [24]

กลุ่มผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างเป็นเพอรอฟสไกต์นั้น เป็นกลุ่มผลึกที่มีการศึกษากัน มากกลุ่มหนึ่ง โดยชื่อเพอรอฟสไกต์นั้นเป็นชื่อที่เรียกตามชื่อโครงสร้างของแร่แคลเซียมไททาเนต (CaTiO₃) มีสูตรโครงสร้างทั่วไปเป็น ABO₃ ดังภาพ 4 เมื่อ A และ B เป็นไอออนบวก (cation) และมี ขนาดไอออนที่แตกต่างกันโดย A เป็นไอออนบวกที่มีขนาดใหญ่กว่า B โดยทั่วไปโครงสร้างเพอรอฟส ไกต์นั้นแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

2.4.1 โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ในอุดมคติ (ideal-perovskite structure) [Ref]

โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ในอุดมคตินั้นเป็นโครงสร้างที่มีความสมมาตรสูง และเป็นเฟสคิวบิก พาราอิเล็กทริกที่เกิดจากเฟร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิคูรี ดังภาพ 4 ซึ่งโครงสร้างเพ อรอฟสไกต์นี้มีพื้นฐานมาจากหน่วยเซลล์แบบลูกบาศก์กึ่งกลางหน้า (face-center cubic :FCC) โดย ที่ไอออนบวกในตำแหน่ง A (A-site) ซึ่งมีขนาดรัศมีไอออนใหญ่จะจัดเรียงตัวสลับกับไอออนลบของ ออกซิเจนเกิดเป็นโครงสร้าง แบบ FCC และมีค่าประจุต่ำกว่า อาทิเช่น K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺ และ Pb²⁺ สำหรับไอออนบวกในตำแหน่ง B (B-site) ซึ่งมีขนาดรัศมีไอออนเล็กจะเข้าไปอยู่ในช่องว่าง ทรงแปดหน้า (octahedral hold) ที่เกิดจากออกซิเจน และมีค่าความประจุสูงกว่า อาทิเช่น Ta⁵⁺, Nb⁵⁺, Ti⁴⁺, Zr⁴⁺ และ Sn⁴⁺ ไอออน B จะมีเพียงไอออนลบของออกซิเจนล้อมรอบอยู่ 6 ไอออน และ ในแต่ละไอออนลบของออกซิเจนจะมีไอออนบวก A และ B ล้อมรอบอยู่ 4 และ 2 ไอออน ตามลำดับ



ภาพ 4 โครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ (ABO3) [25]

2.4.2 โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อน (complex perovskite structure) โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนนี้จะแตกต่างจากโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ในอุดมคติ โดยที่ ตำแหน่ง A และ B นั้นจะมีไอออนบวกของธาตุได้หลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น เลดแมกนีเซียมไนโอเบต (Pb(Mg_{1/2}Nb_{2/3})O₃), เลดซิงค์แทนทาเลต (Pb(Zn_{1/3}Ta_{2/3})O₃), เลดโคบอลต์ไนโอเบต (Pb(Co_{1/3}Nb_{2/3})O₃), เลดแบเรียมเซอร์โคเนต ((Pb_{1-x}Ba_x)ZrO₃), แบเรียมสตรอนเชียมไททาเนต ((Ba_{0.60}Sr_{0.40})TiO₃) และ เลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไททาเนต ((Pb_{1/x}La_{2x/3})(Zr_{1/y}TiO_y)O₃) เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

- 1. โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง A [(A´A´´)BO₃]
- 2. โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง B [A(B´B´´)O₃]
- 3. โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง A และตำแหน่ง B (A´A´´)(B´B´´)O₃

โดยไอออนบวกที่ตำแหน่ง A และ B นั้นจะเรียงในหน่วยเซลล์ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (ภาพ 5) เช่น โครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง B [A(B´B´´)O₃] โดยที่ A = A²⁺ หรือ A³⁺; B´= B⁺, B²⁺, B³⁺; B´´= B⁴⁺, B⁵⁺, B⁶⁺ ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 ไอออนบวกขอ<mark>งธาตุ</mark>ที่ตำแหน่ง A B´ และ B´´ ที่เป็นไป<mark>ได้ พ</mark>ร้อมตัวอย่างโครงสร้างเพ อรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่ตำแหน่ง B [26]

ตำแหน่ง A	ตำแหน่ง B′	ตำแหน่ง B´´	ตัวอย่าง
A ²⁺ = Ba ²⁺ , Sr ²⁺ , Ca ²⁺ , ฯลฯ	Li ⁺ , Zn ²⁺ , Mg ²⁺ , La ³⁺ , Gd ³⁺ , Sm ³⁺ , Ni ³⁺ , ฯลฯ	Ti ⁴⁺ , Zr ⁴⁺ , Hf ⁴⁺ , Sn ⁴⁺ , Ta ⁵⁺ , Sb ⁵⁺ , W ⁶⁺ , ฯลฯ	Sr ²⁺ (Zn ²⁺ , Sb ⁵⁺)O ₃ , Ba ²⁺ (La ³⁺ , Ta ⁵⁺)O ₃ , Ca ²⁺ (Ni ³⁺ , Ti ⁴⁺)O ₃
A ³⁺ = Bi ³⁺ , La ³⁺ , Sm ³⁺ , ฯลฯ	Li ⁺ , Zn ²⁺ , Mg ²⁺ , La ³⁺ , Gd ³⁺ , Sm ³⁺ , Ni ³⁺ , ໆລໆ	Ti ⁴⁺ , Zr ⁴⁺ , Hf ⁴⁺ , Sn ⁴⁺ , Ta ⁵⁺ , Sb ⁵⁺ , W ⁶⁺ , ฯลฯ	$Bi^{3+}(Li^+, Ti^{4+})O_3,$ $Bi^{3+}(Mg^{2+}, Hf^{4+})O_3,$ $Bi^{3+}(Zn^{2+}, Ta^{5+})O_3,$ $La^{3+}(Mg^{2+}, Ta^{5+})O_3,$



ภาพ 5 แสดงโครงสร้างเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนที่มีไอออนที่ตำแหน่ง A และ B หลายชนิด

(ก) (A´A´´)BO₃ และ (ข) A(B´B´´)O₃ [25]

2.5 สมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric property) [27]

วัสดุไดอิเล็กทริกเป็นวัสดุชนิดหนึ่งของฉนวน ซึ่งไม่นำไฟฟ้า และสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ อีกด้วย โดยค่าความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริกเรียกว่า ค่าความจุไฟฟ้า (capacitance) เมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่วัสดุไดอิเล็กทริก วัสดุไดอิเล็กทริกจะเกิดโพลาไรเซชัน ขึ้น เท่ากับค่าผลรวมของโพลาไรเซชันต่อหน่วยปริมาตร (net polarization/unit volume) ซึ่งถ้าค่าโพ ลาไรเซชันสูงก็จะส่งผลให้วัสดุไดอิเล็กทริกมีค่าความจุไฟฟ้าสูงตามไปด้วย โดยสมบัติทางไดอิเล็กทริก มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity; *E*) ความ คงทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) และค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss; tan *ป*ิ

2.5.1 ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity: \mathcal{E}_r)

พิจารณาตัวเก็บประจุอย่างง่ายคือ แผ่นขนานที่ทำด้วยโลหะโดยวางห่างกันด้วยระยะ d พื้นที่ ของแผ่นเท่ากับ A ดังแสดงในภาพ 6 ระหว่างแผ่นขนานเป็นสุญญากาศ เมื่อมีศักย์ไฟฟ้า V คร่อม แผ่นขนานโดยที่แผ่นโลหะแผ่นประจุ +Q และอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุ –Q ค่าประจุนี้จะเป็นสัดส่วน กับ V ดังสมการ 2.5

$$Q = CV$$
(2.5)
$$C = \frac{C}{V}$$
(2.6)

้เมื่อ C <mark>คือ (capacitance) มีหน่วยเป็น คูล</mark>อมบ์ต่อโวลต์ (C/V) หรือ ฟารัด (F)



ภาพ 6 ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน [27]

ความจุไฟฟ้าบอกถึงความสามารถในการกักเก็บประจุ ยิ่งมีความจุไฟฟ้ามากเท่าใดยิ่งเก็บ ประจุได้มากเท่านั้น ถ้าหากตัวเก็บประจุมีขนาดพื้นที่ขนานมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นขนานมากๆ จะได้ว่าความจุไฟฟ้ามีค่าดังสมการ (2.7)

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$
(2.7)

เมื่อ \mathcal{E}_0 คือค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (permittivity) ในสุญญากาศ มีค่า 8.854imes10⁻¹² ฟารัดต่อเมตร F/m

A คือพื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m²)

C คือค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด (F)

d คือความหนา<mark>ของส</mark>ารไดอิเล็กทริก <mark>มีหน่ว</mark>ยเป็นเมตร (m)

ในกรณีที่มีสารไ<mark>ดอิเ</mark>ล็กทริกวางอยู่ระหว่างแผ่นขนาน <mark>ความ</mark>จุไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน เท่าซึ่งเท่ากับค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity: *E*_r) หรือที่เรียกว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) ของเซรามิก ดังสมการ 2.8

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_o A}{d}$$

(2.8)

Er คือค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity)

 \mathcal{E}_0 คือค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (permittivity) ในสุญญากาศโดยมีค่าประมาณ $8.854 imes 10^{-12}$ ฟารัดต่อเมตร F/m

A คือพื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m²)

C คือค่<mark>าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟารัด (F)</mark>

d คือความหนาของสารไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

การมีสารไดอิเล็กทริกอยู่ในตัวเก็บประจุจะช่วยเพิ่มพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุให้สามารถ สร้างตัวเก็บประจุขนาดเล็กแต่ความจุไฟฟ้าสูงได้

2.5.2 ความคงทนไดอิเล็กทริก (Dielectric strength)

ความคงทนไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพของไดอิเล็กทริก เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความทนทานต่อความต่างศักย์ของไดอิเล็กทริก ความคงทนไดอิเล็กทริกมีค่า เท่ากับศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ไดอิเล็กทริกยังคงใช้งานได้ โดยปราศจากความเสียหายต่อความยาวหนึ่ง หน่วย ถ้าวัสดุไดอิเล็กทริกถูกป้อนด้วยค่าความค่างศักย์ที่สูงมากๆ อาจจะทำให้แฟกเตอร์สูญเสีย พลังงาน (energy loss factor) ถ้าป้อนความต่างศักย์ไฟฟ้าให้แก่ สารไดอิเล็กทริกที่ไม่มีการสูญเสีย พลังงานเลย ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบซายน์ แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะน้ำหน้า ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบซายน์ แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะน้ำหน้าศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90 องศา แต่ในความเป็นจริงนั้น สำหรับไดอิเล็กทริกทั่วไป มุมต่างเฟสจะน้อยกว่า 90 องศา เสมอ ถ้าให้ *S* คือค่ามุมที่น้ำไปลบออกจาก 90 องศา ปริมาณ tan*S* จะหมายถึงแฟกเตอร์สูญเสีย พลังงาน ในไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเมื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2.5.3 ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss)

ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับกับสารไดอิเล็กทริกนั้น ขั้วคู่ทางไฟฟ้าหรือไดโพลในเนื้อ สารจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปมา ซึ่งการที่จะเปลี่ยนได้ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ของ สนามไฟฟ้าที่ให้ โดยถ้าความถี่สูงเกินไปจะทำให้ไดโพลไม่สามารถปรับตัวให้ทันตามความถี่ทำให้เกิด การหยุดนิ่งของไดโพลเนื่องจากความเอื่อย เมื่อหยุดนิ่งนานๆจะท้าให้เกิดความร้อนขึ้น (loss) ซึ่ง ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่มาของค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss: tan δ) การใช้งานของ วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแทบจะทุกชนิดมีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าดังนั้น การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า ของวัสดุจึงมีความจำเป็นอย่างมากซึ่งค่าสภาพยอมสัมพัทธ์เป็นสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของวัสดุเพีย โซอิเล็กทริก ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง (high dielectric consta<mark>nt) อยู่ในช่วง 200</mark>—10000 เทียบกับ วัสดุที่เป็นฉนวนมี<mark>ค่าสภาพยอม</mark>สัมพัทธ์สูง 5-100 เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานทางด้านตัวเก็บประจุ

2. มีค่าการสูญเสียสมบัติไดอิเล็กทริกต่ำ (low dielectric constant) อยู่ในช่วง 0.1%—7%

3. มีสภาพความต้านทานทางไฟฟ้าสูง (high specific electric resistivity) > $10^{13}~\Omega$.cm

4. สามารถท<mark>นการเบรกดาวน์ได้พอสมคว</mark>ร (moderate dielectric breakdown) ประมาณ

100— 120 kV/cm สำหรับเม็ดเซรามิกและประมาณ 500—800 kV/cm สำหรับแผ่นเซรามิกบางๆ

2.6 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray diffractometer) [28]

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิง คุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับ วิชาระบบโครงสร้างผลึก รังสีเอกซ์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาว คลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 อังสตรอม การเกิดอันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสสารนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้ วิเคราะห์สารได้ดังนี้

1. ใช้วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี

 3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกหรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์มีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสธาตุกัมมันตรังสีและที่ มนุษย์ผลิตขึ้นจากกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออะตอมได้รับการกระตุ้นด้วยอิเล็กตรอนที่มี พลังงานสูงวิ่งชนอะตอม ทำให้เกิดอันตรกิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนชั้นวงโคจรต่าง ๆ ของ อะตอมมีค่าสูงขึ้นเกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น กระบวนการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอนออกมาในลักษณะพัลส์ (pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระตุ้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า "รังสี เอกซ์" ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณชั้น โคจรอิเล็กตรอน คือ

1. รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดี่ยว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ อิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุชนิดอื่น ๆ หรือโฟตอนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวง โคจรชั้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนชั้นในวงโคจรได้รับพลังงาน เพิ่มสูงขึ้นกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นวงโคจร ทำให้หลุดจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในชั้น วงโคจรขึ้น ทำให้อะตอมอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นและจะลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วง ระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรในชั้นอิเล็กตรอนในชั้น ยึดเหนี่ยวของวงโคจรในชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วง ระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรในชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงาน ยึดเหนี่ยวของวงโคจรชั้นในด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามา แทนที่ช่องว่างของวงโคจรชั้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยว เฉพาะวงโคจรของอิเล็กตรอน และชนิดชองธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

 รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุด ถึง สูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคู ลอมบ์ (coulomb field) บริเวณใกล้นิวเคลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตบริเวณดังกล่าว ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว และปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาก่อนที่อิเล็กตรอนปฐมภูมิจะ ทำอันตรกิริยากับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้นิวเคลียสที่เกิดจากประจุของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสีย พลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอน ดังนั้นพลังงานของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมี ค่ากระจายต่อเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปฐมภูมิ ถ้าอิเล็กตรอนปฐมภูมิมี พลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอมหลุดออกได้ก็จะเกิดรังสีเอกซ์ เฉพาะค่าปะปนซ้อนอยู่กับสเปกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ

การปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาที่ความยาวคลื่นใด ๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมา ซึ่งความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดเกิดจากการที่อิเล็กตรอนคายพลังงานที่ได้รับมาทั้งหมดจากแหล่งกำเนิด โดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวหน้าของผลึกโดยทำมุม heta บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการ กระเจิงด้วยชั้นของอะตอมที่ผิวหน้า อีกส่วนหนึ่งของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังชั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่ง บางส่วนจะกระเจิงและส่วนที่เหลือก็จะผ่านเข้าไปยังชั้นที่ 3 ขอ<mark>งอะต</mark>อมดังภาพ 7



ภาพ 7 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกก์

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กันลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลำขนานกัน สิ่งสำคัญใน การเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับภาวะ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกกระทบ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวหน้าจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมควรมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์

เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกก์ได้ยิ่งลำรังสีเอกซ์แคบ ๆ กระทบผิวหน้าผลึกเป็นมุม hetaเพื่อให้เกิดการ เลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อเกิดอันตรกิริยากับอะตอม *O, P* และ *R* ถ้า

$$SQ+QT=n\lambda$$
 (2.9)

เมื่อ n คือจำนวนเต็มรังสีที่กระเจิงจะอยู่ในเฟส OCD ผลึกก็จะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin \theta$$
 (2.10)

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$
 (2.11)

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกก์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับ การศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดี่ยว (single crystal) และผลึก เชิงซ้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็น ลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่ามุมที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์เมื่อชนกับอะตอมของสาร เราจะทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการ วิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วย การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิช *c, a* และค่าอัตราส่วน *c*/*a* สามารถกระทำได้โดยอาศัยข้อมูลจาก เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน และจากสมการที่ (2.12)

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(2.12)

ในระบบเททระโกนัลนั้น ค่าแลตทิช a มีค่าเท่ากับแลตทิช b แต่ไม่เท่ากับแลตทิช c (a = b ≠ c) ดังนั้น จากสมการที่ (2.12) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(2.13)

หรือ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = (h^2 + k^2) + \frac{l^2}{(c/a)^2}$$
(2.14)

สำหรับเลดไททาเนตสามารถคำนวณหาค่าอัตราส่วน *c/a* ได้โดยนำค่า d-spacing *d*₀₀₂ และ *d*₂₀₀ มาคำนวณตามสมการ (2.15)

$$c/a = \frac{d_{002}}{d_{200}} \tag{2.15}$$

2.7 ความหนาแน่น (density) [29]

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่ง หน่วยของค่าความ หนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร (g/ml), กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³), กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร (Kg/m³) เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร (g/cm³) ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเซรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็น ตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณ นั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุใด้อีกด้วย การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้น อาศัยหลักการของอาร์คิมีดีสที่กล่าวไว้ ว่า "เมื่องุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบน ของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่า เท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของ ของแข็ง" วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวล ของวัตถุในอากาศและขณะที่งุ่มอยู่ในน้ำสามารถคำนวณ ตามสมการ (2.16)

ความหนาแน่น
$$ho = rac{W_a}{W_a - W_{fl}} \bullet
ho_{fl}$$
 (2.16)

เมื่อ **p** คือค่าค<mark>วามหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วย</mark>เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³)

 ho_{fl} คือค่าความหนาแน่นของของเหลว หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³)

W_a คือน้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม (g)
 W_{fl} คือน้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม (g)

สำหรับในส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในกรณีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของ ของแข็งที่ใส่ลงไปจะสามารถคำนวณตามสมการ (2.17)
$$\rho_{fl=G/V} \tag{2.17}$$

โดยที่ G คือแรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็งหาได้จากนน้ำหนักของชิ้นงานในอากาศลบด้วย น้ำหนักของชิ้นงานในของของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม (g)

V คือปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร (cm³)

สำหรับการหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, $oldsymbol{
ho}_{
m r}$) นั้นสามารถคำนวณตาม สมการ (2.18)

$$\rho_r(\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_{th}}\right) \times 100 \tag{2.18}$$

เมื่อ ho_r คือค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

 ho_b คือ<mark>ค่าค</mark>วามหนาแน่นของชิ้<mark>นงาน มีหน่ว</mark>ยเป็นกรัมต่อลูกบ<mark>าศก์</mark>เซนติเมตร (g/cm³)

 ho_{th} คือค่าความหนาแน่นทฤษฎี มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³)

2.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM) [30]

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมดาและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มี ข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกนอกจากจะขึ้นกับลักษณะของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยก ขณะ ขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยังมองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าส่วนนั้นเป็น อะไร ต่อมาได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้อง จุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์กระจก เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้าง หรือองค์ประกอบ พื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อ และวัตถุได้โดยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มของ เงาแตกต่างกัน

หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะ ถูกเร่งด้วยศักย์ไฟฟ้าสูง (1,000 ถึง 3,000 อิเล็กตรอนโวลท์หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้ จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสุญญากาศ 10⁻⁵–10⁻⁷ทอร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็ก ลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิ่งลงสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์วัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิวตัวอย่างพอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตก กระทบผิววัตถุ หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขดลวดควบคุมการส่อง กราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอน ทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอน บนผิวตัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอน กระทบผิวตัวอย่างจะเกิดอันตรกีริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมธาตุในวัตถุ หรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการ ปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมา ซึ่งใช้ประโยชน์ในการศึกษา ลักษณะผิวของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณ อิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ

 สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron Image, SEI) หรือเป็น อิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวระดับไม่ลึก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิด กับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิวต่ำ

 สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (backscattered electron Image, BEI) หรือ เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในชิ้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมา ซึ่ง มีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวระดับลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้ดีกับธาตุที่มี เลขอะตอมสูง

3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M,...) ถูกกระตุ้น (excited) หรือ ได้รับพลังงานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรออกมา ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวม ภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นวงโคจรถัดไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกิน ออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพปรากฏบนจอรับภาพ ได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอน ทุติยภูมิใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจาก อิเล็กตรอนกระเจิงกลับจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อพีเอ็น (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ จะใช้หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนลิเทียม (lithium drifted silicon, Si(Li)) ทำงาน ร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่อง เดี่ยว (single channel analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (multi-channel analyzer, MCA)

2.9 รามานสเปกโตสโคปี (raman spectroscopy) [31]

การวิเคราะห์โดยรามานสเปกโตสโคปีอาศัยหลักการกระเจิงของแสง ที่เกิดจากอนุภาคของ แสงเข้าชนโมเลกุลของสาร สมมติให้แสงเลเซอร์มีความยาวคลื่นค่าหนึ่งผ่านสารของเหลวที่โปร่งแสง จะมีอนุภาคแสงจำนวนหนึ่งที่ทะลุผ่านไป ขณะที่บางส่วนจะชนเขากับโมเลกุลสารแล้วเปลี่ยนทิศทาง ในการชนกันนั้นโดยส่วนมากพลังงานของแสงหลังการชนจะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นการชนแบบ ยึดหยุ่น ที่เรียกว่าการกระเจิงแบบเรย์ลี (Rayleigh scattering) แต่จะมีอนุภาคแสงส่วนน้อยที่ พลังงานหลังการชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับโมเลกุลของสาร หรือ เรียกว่าเป็นการชนแบบไม่ยึดหยุ่น โดยแสง อาจมีความถิ่มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ การเปลี่ยนแปลง พลังงานหลังเกิดการชนนี้เรียกว่าการกระเจิงแสงแบบรามาน (raman scattering) หากอนุภาคแสง เข้าชนโมเลกุลในสภาวะพื้น ความถี่หลังการชนจะลดลง เรียกว่า stokes raman scattering แต่หาก อนุภาคแสงเข้าชนโมเลกุลในสภาวะกระตุ้น ความถี่หลังการชนจะเพิ่มขึ้น เรียกว่า anti-stokes raman scattering (ภาพ 8) โดยทั่วไปแล้วนิยมวัดการเกิด stokes raman scattering เนื่องจากสาร จะอยู่ในสภาวะพื้น (ภาพ 9) นอกจากนี้สารแต่ละชนิดจะเปลี่ยนความถี่ของแสงได้แตกต่างกัน และ ยังให้ความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมาไม่เท่ากันอีกด้วย จึงสามารถนำวิธีรามานสเปกโตสโคปี (raman spectroscopy) มาใช้ในการศึกษาโครงสร้างของสารได้



ภาพ 8 การกระเจิงของแสงแบบต่างๆ เมื่อชนโมเลกุลของสาร [32]



ภาพ 9 แผนภาพเปรีย<mark>บเท</mark>ียบการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล<mark>็กตร</mark>อนในปรากฏการณ์ต่าง ๆ [33]

2.10 เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีสำหรับเซรามิกไฟฟ้า (Impedance spectroscopy) [34,35]

เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี (Impedance spectroscopy: IS) เป็นวิธีการตรวจวัดที่ สามารถบ่งบอกค่าอินพีแดนซ์หรือสภาพต้านทานรวมของวัสดุ นอกจากนี้ยังสามารถระบุชนิดของ กลไกการนำไฟฟ้าและสัดส่วนขององค์ประกอบจุลภาค (เช่น เกรน ขอบเกรน ขั้วไฟฟ้า) ที่มีผลต่อ ค่าความต้านทานรวมได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับความนิยมในการใช้ศึกษาพฤติกรรมการนำไฟฟ้าของ วัสดุเซรามิกไฟฟ้าต่างๆ อย่างแพร่หลาย เช่น แบเรียมไททาเนต (BaTiO₃) และ CaCu₃Ti₄O₁₂ (CCTO) เป็นต้น หลักการของวิธีการวัดโดยเทคนิค IS ในเซรามิกไฟฟ้าทำได้โดยการป้อน สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับแก่ตัวอย่างในช่วงความถี่ที่ค่อนข้างกว้าง (ประมาณ 10⁻²-10⁷ Hz) จากนั้นจึงวัดสัญญาณการตอบสนองในรูปของกระแสไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า หรือสัญญาณอื่นๆ ที่สนใจ ข้อมูลที่ได้สามารถถูกนำไปวิเคราะห์ได้ 4 รูปแบบ คือ (1) อิมพีแดนซ์เชิงซ้อน (complex impedance: Z*) (2) มอดุลัสไฟฟ้าเซิงซ้อน (electric modulus: *M**) (3) ความนำไฟฟ้า เชิงซ้อน (admittance: Y*) และ (4) สภาพยอมสัมพัทธ์เชิงซ้อน (permittivity: e*) โดยข้อมูลทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้

$$M^* = j\omega C_o Z^* \tag{2.19}$$

$$\varepsilon^* = (M^*)^{-1} \tag{2.20}$$

$$Y^* = (Z^*)^{-1} (2.21)$$

$$Y^* = j\omega C_o \varepsilon^* \tag{2.22}$$

เมื่อ $\omega = 2\pi f$ คือความถี่เชิงมุม และ C_0 คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุที่มีตัวกลางเป็น สุญญากาศ

หากพิจารณาข้อมูลที่ได้จากเทคนิค IS จะสามารถแบ่งวัสดุได้เป็น 2 ประเภทจากโครงสร้าง จุลภาคเซิงไฟฟ้า (electrical microstructure) คือ 1) เชรามิกที่มีโครงสร้างจุลภาคเซิงไฟฟ้าแบบ เอกพันธ์ (homogeneous electrical microstructure) หรือมีเพียงองค์ประกอบเดียว และ 2) เซรามิกที่มีโครงสร้างจุลภาคเซิงไฟฟ้าแบบวิวิธพันธ์ (heterogeneous electrical microstructure) ซึ่งจะมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าหลายองค์ประกอบเช่น เกรน ขอบเกรน และ ขั้วไฟฟ้า โดยเซรามิกที่มีโครงสร้างจุลภาคเซิงไฟฟ้าแบบเอกพันธ์จะแสดงครึ่งวงกลม (semicircle) เพียงวงเดียวในกราฟอิมพีแดนซ์เซิงซ้อน (complex plane plot: Z* plot) ซึ่งเป็นกราฟระหว่าง ค่าอิมพีแดนซ์จริง (Z) และค่าอิมพีแดนซ์จินตภาพ (Z') ในขณะเดียวกันหากนำข้อมูล IS ไป วิเคราะห์โดยใช้กราฟสเปกโทรสโคปิกของค่าอิมพีแดนซ์ (Z''(f) plot) ซึ่งเป็นกราฟระหว่างส่วน จินตภาพของอิมพีแดนซ์ (แกน y) กับลอการิทีมของความถี่ (แกน x) จะปรากฏพีคเดอบาย (Debye peak) แบบพีคเดี่ยว ส่วนเซรามิกที่มีโครงสร้างจุลภาคเชิงไฟฟ้าแบบวิวิธพันธ์จะมีความ ซับซ้อนของข้อมูล IS มากกว่า โดยจะมีครึ่งวงกลมรวมถึงพีคเดอบายที่อาจซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้น การแปรผลข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำสูงสุดจะต้องวิเคราะห์ Z''(f) ควบคู่กับกราฟสเปกโทรส โคปิกของค่าโมดูลัสจินภาพ (*M*''(f)) นอกเหนือไปจากการพิจารณากราฟ *Z**

โดยทั่วไปโครงสร้างจุลภาคเชิงไฟฟ้าของแต่ละองค์ประกอบในเซรามิกเช่น เกรน ขอบเกรน และขั้วไฟฟ้า จะสามารถแทนได้โดยใช้วงจรไฟฟ้าสมมูลที่เกิดจากการต่อแบบขนานระหว่างตัว ต้านทาน (*R*) และตัวเก็บประจุ (*C*) โดยผลคูณของค่า *R* และ *C* ถูกเรียกว่าค่าคงที่เวลา (time constant: *RC*) ซึ่งเป็นค่าคงที่ ในกรณีเซรามิกแบบเอกพันธ์จะมี 1 วงจรขนาน *RC* (ภาพ 10 (ก)) หากมีหลายองค์ประกอบก็จะนำแต่ละวงจรขนาน *RC* มาต่ออนุกรมกันดังแสดงในภาพ 10(ข) โดย จุดข้อมูลใดๆ ในกราฟ *M* "(*f*) และ *Z* "(*f*) สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการที่ (2.23) และ (2.24)

$$M'' = \frac{C_0}{C} \left[\frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \right]$$
(2.23)

$$Z'' = R \left[\frac{\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \right]$$
(2.24)

จาก สมการ (2.23) และ (2.24) จะพบว่าตำแหน่งสูงสุดของจุดข้อมูลในกราฟ *M* "(*f*) และ *Z* "(*f*) สามารถอธิบายได้โดยใช้สมการ (2.25)

$$\omega_{\rm max} = 2\pi f_{\rm max} = (RC)^{-1}$$
 (2.25)

เมื่อ f_{\max} คือ ความถี่ ณ ค่าสูงสุด (พีค) ของกราฟ M "(f) และ Z "(f)

- RC คือ ค่าคงที่เวลา
- ω คือ ความถี่เชิงมุม

ค่าของจุดสูงสุด M''_{max} และ Z''_{max} สามารถคำนวณได้โดยการแทนที่สมการ (2.25) ในสมการ (2.23) และ (2.24) ดังนี้

 $Z''_{\text{max}} = \frac{R}{2}$

$$M_{\max}^{"} = \frac{C_0}{2C} = \frac{1}{2\varepsilon_r}$$
(2.26)

(2.27)

สมการ 2.26 จึงบอกให้เราทราบว่าพีคเดอบายที่มีขนาดมากที่สุดในกราฟ M"(f) จะเกิด จากองค์ประกอบในเซรามิกไฟฟ้าที่มีค่า C น้อยที่สุด (ซึ่งโดยมากมักเป็นเกรน) ในทำนองเดียวกัน สมการ 2.27 บ่งชี้ว่าองค์ประกอบที่มีค่า R มากที่สุดซึ่งโดยมากเกิดจากขอบเกรนจะแสดงพีคที่มี ขนาดสูงสุดในกราฟ Z"(f) ดังนั้นเซรามิกที่มีโครงสร้างจุลภาคเชิงไฟฟ้าแบบเอกพันธ์ซึ่งมี ค่าคงที่เวลาเดียวจะแสดงพีคเดอบายเพียงพีคเดียวทั้งในกราฟ M"(f)และ Z"(f) ที่ความถื่ เดียวกัน ในทางตรงกันข้ามเซรามิกแบบวิวิธพันธ์ที่มีหลายองค์ประกอบเช่น เกรน ขอบเกรน และ ขั้วไฟฟ้า จะเกิดพีคในกราฟ Z"(f) และ M"(f) ที่ความถี่ต่างกันและมีขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบนั้นๆ



ภาพ 10 วงจรสมมูลไฟฟ้าอย่างง่ายของวัสดุไดอิเล็กทริก (ก) แบบเอกพันธ์ (homogeneous electrical microstructure) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว (ข) แบบวิวิธพันธ์ (heterogeneous electrical microstructure) ซึ่งมีองค์ประกอบทางไฟฟ้าของเกรน ขอบเกรน และขั้วไฟฟ้า [35]

2.11 กระบวนการเตรียมแบบปฏิกิริยาสถานะของแข็ง [36]

การเตรียมวัสดุผงจากปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (solid state reaction) เป็นวิธีการที่อาศัย การ เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นที่มีสถานะของแข็งผสมกันอยู่ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการ เตรียมผงพวกสารประกอบออกไซด์เชิงซ้อนโดยใช้สารตั้งต้น ในกลุ่มคาร์บอนคาร์บอเนต ไนเตรต ซัล ไฟล์แอซิเตท และออกซาเลต การสังเคราะห์สารแบเรียมออธอไททาเนต (Ba₂TiO₄) ได้จากการทำ ปฏิกิริยาระหว่า<mark>งแบ</mark>เรียมคาร์บอเนต (BaCO₃) และแบเรียมไททาเนต (BaTiO₃) ดังสมการที่ 2.28

$$BaCO_{3}(s) + TiO_{2}(s) \longrightarrow BaTiO_{3}(s) + CO_{2}(g)$$
(2.28)

แบเรียมคาร์บอเนต (BaCO₃) และแบเรียมไททาเนต (BaTiO₃) สามารถเตรียมได้โดยการบด ย่อยด้วยลูกบดแบบบดเปียก (wet ball milling) หลังจากนั้นทำให้สารละลายแห้งจนกลายเป็น ของแข็งที่มีส่วนผสมของแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO₃) และแบเรียมไททาเนต (BaTiO₃) จากนั้นให้ ความร้อนเพื่อให้เกิดการสลายตัวหรือเกิดปฏิกิริยากันระหว่างสารตั้งต้นต่างชนิดกันแล้วเกิดเป็นชนิด ใหม่ขึ้นมากระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การเผาแคลไซน์ (calcination) มีปัจจัยอยู่หลายประการที่มี อิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยาสถานะของแข็งระหว่างอนุภาคผงของตัวทำปฏิกิริยาเช่น ธรรมชาติทาง เคมีของตัวทำปฏิกิริยา และสารที่เกิดขึ้นใหม่ขนาดของอนุภาค ลักษณะการกระจายตัวของอนุภาค ความแตกต่างของอนุภาคในวัสดุผงผสมความเป็นเนื้อเดียวกัน ของผงผสมสภาวะของบรรยากาศ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยาโดยทั่วไปแล้วถ้าใช้อนุภาคของวัสดุผงที่มีขนาดใหญ่ อัตราการเกิดปฏิกิริยาในวัสดุผงผสมก็จะลดลงเนื่องจากอนุภาคของวัสดุผงต้องเคลื่อนที่ด้วยระยะทาง ที่ไกลขึ้นนอกจากนี้คุณภาพของการผสมอนุภาคของตัวทำปฏิกิริยาก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อ ระยะทางในการแพร่และปริมาณพื้นที่ผิวที่อนุภาคสัมผัสกันอีกด้วยการเตรียมวัสดุผงจากปฏิกิริยา สถานะของแข็งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย วัสดุผงที่เตรียมได้มักจะมีปัญหาเรื่องการเกาะกลุ่มกันเป็น ก้อนโต (agglomeration) ทำให้ต้องมีการบดย่อยลดขนาดอยู่เสมอเนื่องจากการบดย่อยต้องมีการใช้ ลูกบด (media ball) จึงมีโอกาสทำให้วัสดุผงที่เตรียมได้มีสารแปลกปลอม (contamination) ปะปน มาด้วยและเมื่อนำไปใช้อาจจะทำให้เกิดเฟสที่ไม่ต้องการ เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ได้

2.12 กระบวนการบดย่อยผสมด้วยลูกบอล [37]

กระบวนการเตรียมผงให้มีขนาดเล็กด้วยการทำให้อนุภาคขนาดใหญ่แตกออกโดยอาศัย แรงกล เรียกว่า การบด (comminution) ซึ่งได้แก่ การบดหยาบ (clushing) การบดละเอียด (grinding) และการบดย่อย (milling) กระบวนการเหล่านี้ได้รับความนิยมสูงในการนำมาใช้เพื่อลดค่า ้ขนาดอนุภาคผงเฉลี่ยใช้ทำ<mark>ลายอนุภาค</mark>ผงที่<mark>มีรูพรุนหรือสิ่งแปลกปลอ</mark>มฝังอยู่ข้างในให้แตกออกช่วย ้ปรับพฤติกรรมการแจกแจงอนุภาคด้วยการลดขนาดของอนุภาคที่โตที่สุดลง ทำให้จำนวนของอนุภาค ้ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ช่<mark>วยป</mark>รับปรุงรูปร่างของอนุภาค ช่วยแยกก<mark>ลุ่ม</mark>ก้อนหรือกระจุกอนุภาคออกจาก ้กัน และนอกจากนี้ยังสามารถนามาใช้ในการผสมอนุภาคผงต่างชนิดกันให้เกิดการผสมผสานเข้าไป พร้อมๆ กับการล<mark>ดข</mark>นาดของอนุ<mark>ภาคกระบวนการบด</mark>ย่อยด้วยลูกบอล (ball-milling) ก็เป็นเทคนิค หนึ่งที่นิยมใช้ใน<mark>ปัจจุ</mark>บันซึ่งเป็นกระบวนการ<mark>บดย่อยผส</mark>มอนุภาคโดยอาศัย<mark>การ</mark>หมุน<mark>ห</mark>ม้อบด ซึ่งเป็นแท่ง ึกลวงทรง<mark>กระบอกม</mark>ีฝาเปิด-ปิดอยู่ปลายด้านหนึ่ง ดังภาพ 11 สำหรับหม้<mark>อบด</mark>ในร<mark>ะ</mark>ดับห้องปฏิบัติการ ้มักทำด้วย<mark>พ</mark>ลา<mark>สติก ที่สามา</mark>รถกำจัดเศษพลาสติกที่ปนเปื้อ<mark>นมากับการบ</mark>ดย่อยได้ด้วยการเผาที่ ้อุณหภูมิต่ำ ในหม้อบดจ<mark>ะมีการใ</mark>ส่สารที่จะทำการบดผสมพร<mark>้อมลูก</mark>บอลบด (grinding media) และ ้สารที่ช่วยในการหล่<mark>อลื่น ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของหม้อ</mark>บด โ<mark>ดยจะต้องพยายามปรับ</mark> อัตราส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้ในหม้อบด ให้ระบบทั้งชุดสามารถเกิดพฤติกรรมการบดย่อย กล่าวคือ ลักษณะของลูกบดจะต้<mark>องเคลื่อนที่ในลักษณะคล้</mark>ายกับตัวอักษร D โดยมีการเคลื่อนที่จาก ตำแหน่ง B ขึ้นไปจนถึงตำแหน่ง A แล้วตกลงมากระแทกกับวัสดุด้านล่าง จากนั้นมีการหมุน เบียดเสียดกัน และมีการเลื่อนไหลเป็น วัฏจักรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ทำให้อนุภาคของสารมีขนาดลดลง

เนื่องจากการกระแทกของลูกบดระหว่างหม้อบด และลูกบดกับผนังหม้อบดในขณะที่ พฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้อนุภาคมีขนาดลดลง การเกิดสิ่งเจือปนก็อาจมีขึ้นในขั้นตอนเหล่านี้ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของลูกบด หรือผนังของหม้อบดที่สึกกร่อนหลุดปะปนออกมาด้วย ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยการเลือกใช้ลูกบดที่มีคุณภาพสูง และหม้อบดที่สามารถกำจัด ออกได้ที่อุณหภูมิต่ำเช่น หม้อบดพลาสติก เป็นต้น



ภาพ 11 แสดงภาพตัดขวางแสดงองค์ประกอบหลักของการบดย่อยด้วยลูกบอล

2.13 การแคลไซน์ (calcination) [38]

การแคลไซน์เป็นกระบวนการทางความร้อนที่ทำให้ส่วนประกอบต่างๆ เกิดมีอันตรกิริยาต่อ กัน โดยอาศัยกลไกการแพร่ระหว่างกันของพวกไอออน จึงเป็นวิธีการช่วยลดขอบเขตของการแพร่ที่ จะต้องทำให้เกิดขึ้นในช่วงของขั้นตอนการซินเตอร์ลง เพื่อให้ได้การเป็นตัววัสดุที่มีความเป็นเนื้อ เดียวกัน จึงอาจจะพิจารณาการแคลไซน์ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการผสมสารก็ยังได้ ซึ่ง เงื่อนไขในการเผาแคลไซน์นั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการควบคุมพฤติกรรมการหดตัว ของวัสดุในช่วงการซินเตอร์ เฟสสุดท้ายที่เราต้องการนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้ แต่ เกรเดียนต์ทางเคมีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในสารก็อาจจะไปช่วยเสริมกระบวนการซินเตอร์ได้ใน ภายหลัง สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแคลไซน์นั้นควรจะให้ผลผลิตที่มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นไปตามที่ ต้องการให้มากที่สุด การแคลไซน์สามารถทำได้โดยการใส่อนุภาคผงที่ผ่านกระบวนการชินเตอร์ได้ใน มาแล้วลงในถ้วยหรือเบ้า (crucible) สำหรับเผาสารที่เป็นชุด ๆหรือในการเผาแบบต่อเนื่อง ซึ่งถ้วย เผาสารที่นำมาใช้ก็ควรจะมีฝาปิดด้วยเพราะถ้าหากว่าสารที่จะเผานั้นมีส่วนประกอบทางเคมีที่ สามารถเกิดการระเหยได้ง่าย อย่างเช่น ในกรณีที่มีตะกั่วออกไซต์รวมอยู่ด้วย พื้นผิวของถ้วยเผาสารที่ มีการสัมผัสกับอนุภาคผงโดยตรงจะต้องไม่เกิดการทำปฏิกิริยาเคมีกัน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการ ปนเปื้อนและเพื่อจะนำถ้วยเผาสารกลับมาใช้ไหมได้อีก

เนื่องจากว่าอนุภาคผงเป็นวัสดุที่มีสภาพนำความร้อนต่ำดังนั้นอุณหภูมิที่มีความสม่ำเสมอ เพียงพอจึงมักจะอยู่แถวๆบริเวณที่ลึกลงไปจากผิวหน้าของอนุภาคผงเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้น ถ้า หากว่ามีการใช้อุณหภูมิที่สูงที่สุดเป็นเวลานาน (เช่นปรกติที่ใช้กัน) เพียง 1 หรือ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ กระบวนการแคลไซน์ยังสามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เตาเผาแบบหมุน (rotary kiln) ซึ่ง ประกอบด้วยท่อปลายปิดที่มีการหมุนตัวอย่างช้าๆ ไปรอบๆ แกนหมุนที่มีการวางตัวอยู่ในแนวนอน เริ่มจากการใส่ผงลงมาจากทางด้านบนของท่อจนมาโผล่ที่ด้านล่างในสถานะต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยปรกติแล้ว เตาเผาแบบนี้จะใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันหรือแก๊สเป็นหลัก เนื่องจากว่าผงที่ผ่านการแคลไซน์แล้วมักจะมีการยึดเกาะกันของอนุภาคอยู่ในรูปของก้อน หยาบ จึงต้องนำมาทำการบดย่อยให้เป็นผงละเอียด หรือทำเป็นน้ำสลิปที่มีความเหมาะสมสำหรับ ขั้นตอนการขึ้นรูปต่อไปอีกทีหนึ่ง โดยจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการปนเปื้อนด้วย โดยปรกติการลดขนาดของอนุภาคในช่วงเริ่มต้นเพื่อเตรียมอนุภาคผงให้มีขนาดที่เหมาะสำหรับ กระบวนการบดย่อยในขั้นตอนต่อไปนั้น สามารถจะทำได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่หลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องบดหยาบแบบฟันฉลาม (jaw-crusher) สามารถจะทำให้ก้อนวัสดุที่มีขนาดในระดับ เซนติเมตรลดลงมาอยู่ในระดับมิลลิเมตรได้ ในขณะที่การบดย่อยด้วยค้อน ซึ่งประกอบด้วยการหมุน ของแกนที่มีหนามเหล็กยื่นออกไปรอบทิศทางตีไปยังวัสดุที่ใส่เข้ามา สามารถจะทำให้ได้อนุภาคผงที่มี ขนาดเล็กกว่าที่ได้จากวิธีการใช้เครื่องบดหยาบแบบฟันฉลาม

2.14 การซินเตอร์ (sintering) [39] การซินเต<mark>อร์แ</mark>บบสถานะของแข็ง

้ก<mark>ารซินเตอ</mark>ร์ (sintering) <mark>ค</mark>ือ กร<mark>ะบวนการท</mark>างความร้อนที่ทำให้อนุภา<mark>ค</mark>เกิดการสร้างพันธะ กัน อย่างสมดุล <mark>โดย</mark>มีโครงสร้างหลักเป็นของแข็ง ที่พัฒนามาจากการเค<mark>ลื่อน</mark>ย้ายมวลลักษณะต่าง ๆ ้ที่ มักจะเกิ<mark>ดขึ้นในร</mark>ะดับขอ<mark>ง</mark>อะตอม การเกิดพันธะเชื่อมต่อกันดังกล่าว<mark>ทำให้ระ</mark>บบมีความแข็งแรง ้สูงขึ้น และมีพลัง<mark>งาน</mark>ลด<mark>ลง นอ</mark>กจากนี้ยังอาจจะกล่าวได้ว่าการ<mark>ซินเตอ</mark>ร์นั้<mark>น</mark> หมา<mark>ย</mark>ถึงการกำจัดรูพรุนที่ ้อยู่ระหว่างอ<mark>นุภาคผงเริ่มต้น โดยอา</mark>ศัยการหดตัวขององค์ป<mark>ระกอบที่เชื่อม</mark>อยู่ติดกันแล้วเกิดการเติบโต ้ไปด้วยกัน โด<mark>ย</mark>มีการสร<mark>้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกั</mark>นขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การเปลี่ยนสภาพชิ้<mark>นงานที่ผ่านก<mark>ารอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้</mark>างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกัน</mark> ้ของเกรนต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ ้นั้น ได้มาจากการลดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เชื่อมยึดกันโดยมีพลังงาน ขอบเกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง ($oldsymbol{\gamma}_{
m gb}$) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่กลุ่มอนุภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่าง หลวม ๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ ($\gamma_{
m sv}$) ที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้เองการผลิตเซรามิกส่วน ใหญ่จึงนิยม เลือกใช้อนุภาคผงตั้งต้นที่มีขนาดอนุภาคเล็ก เนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็ ้จะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ ้ชิ้นงาน สามารถเกิดการแน่นตัวได้ดี จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ ต่ำลงได้ การหดตัวของชิ้นงานเซรามิกขณะที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาด หรือหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา

ดังเช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ทั่ว ๆ ไป ที่แสดงดังภาพ 12 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันอยู่คือ

 การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีกครั้ง หนึ่งของอนุภาคผงภายในซิ้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุด สัมผัส ระหว่างอนุภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองแสดงดังภาพ 13 (ข) การ ซินเตอร์ ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความ พรุนใน ชิ้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ ชิ้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่ง เหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องใน ขณะที่ ช่องว่างของรูพรุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อกัน (พวกรูพรุนเปิด) และจะสิ้นสุดพฤติกรรมนี้ ในทันทีเมื่อรูพรุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพรุนปิด) การหดตัวของชิ้นงานจะ เกิดขึ้นมากที่สุด ในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานมีค่าสูง (ภาพ 13 (ค))

 การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย (final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพรุนในชิ้นงานเริ่มปิดตัวเอง ลง และค่อย ๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากชิ้นงานอย่างช้า ๆ โดยอาศัยกลไกการแพร่ของอากาศจากรู พรุนออกมาตามแนวของขอบเกรน แล้วหลุดออกไปจากผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานเกิดการ แน่นตัว เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ แดสงดัง ภาพ 13 (ง)



ภาพ 12 พฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่ว ๆ ไป ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความ หนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา



ภาพ 13 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (ก) อนุภาคผง ยึดกันอยู่แบบหลวม ๆ หลังการอัดขึ้นรูป (ข) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (ค) การซินเตอร์ช่วงกลาง (ง) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย

2.15 การทบท<mark>วน</mark>วรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะเป็นการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงาน ของเซรามิกไร้สารตะกั่วเพอรอฟสไกต์ (ABO₃) โดยการเติมสารประกอบกลุ่มบิสมัส Bi ที่มีโครงสร้าง ตำแหน่ง B ซับซ้อน [B-site complex perovskite: Bi (B´B´´)O₃]

ในปี 2021 Wang และคณะ [40] ทำการศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กทริกและการกักเก็บ พลังงานของเซรามิก (1-x)BaTiO₃-xBi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ ที่ปริมาณ x = 0.08, 0.10, 0.12, และ 0.14 เซรามิกถูกเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง พบว่าเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นจาก 0.08 เป็น 0.12 ค่า สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) เพิ่มขึ้นจาก 175 kV/cm (สำหรับ x = 0.08) เป็น 240 kV/cm (สำหรับ x = 0.12) ส่งผลให้ค่าสูงสุดของความหนาแน่นของพลังงานเพิ่มจาก ~1.2 J/cm³ เป็น ~ 1.71 J/cm³ ตามลำดับ และที่ปริมาณ x = 0.12 มีประสิทธิภาพการเก็บพลังงานสูงถึง 95.6% ดังแสดงใน ภาพ 14 นอกจากนี้ ยังพบการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ต่ำ การเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มี โครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ มีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสจากเฟสเฟร์ โรอิเล็กทริกเป็นเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก และยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานให้ดี ยิ่งขึ้น



ภาพ 14 (a), (b) ความหนาแน่นของพลังงาน (c) ประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (d) ความหนาแน่น ของการกักเก็บพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (W_{rec}) และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (η) ของเซรา มิก (1-x)BaTiO₃-xBi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ (x = 0.08-0.14)

ในปี 2021 Ma และคณะ [41] ได้ทำการศึกษาการเติมสารประกอบกลุ่มบิสมัส Bi ที่มี โครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ (BSN) ที่ x = 0, 0.04, 0.08, 0.12, และ 0.16 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิกโซเดียมไนโอเบต (NaNbO₃) โดยที่การเลือก สาร BSN พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้: (1) การเติม Bi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ จะช่วยลดอุณหภูมิการเผาผนึก ของทั้งระบบและยังช่วยลดการระเหยของธาตุ Na (2) เมื่อ Bi³⁺ แทนที่ Na⁺ ในตำแหน่ง A ของ โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ ส่งผลให้มีตำแหน่งว่างของไอออน นอกจากนี้ การแทนที่ของ Sn⁴⁺ และ Ni²⁺ ลงในตำแหน่ง B จะทำให้เกิดความแตกต่างของไอออนบวก (disorder of cations) และสุดท้ายจะ ช่วยลดค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (remnant polarization: *P*,) [42] (3) เป็นที่ทราบกันดีว่าไอออนบวก ของ Bi³⁺ มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (6s²) แบบอิเล็กตรอนคู่เดียวที่คล้ายคลึงกันกับไอออน Pb^{2+} ซึ่งสามารถทำให้โพลาไรเซชันได้ค่าที่สูง ในระหว่างนี้ การรวมกันของออร์บิทัล 2p ของไอออน O^{2-} และออร์บิทัล 6p ของไออน Bi³⁺ สามารถช่วยทำให้ค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (*P*_{max}) คงค่าที่สูงไว้ได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้คาดการณ์ว่าการเพิ่ม BNS จะช่วยลด *P*, และเพิ่มค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (*E*_b) ในเซรามิก NaNbO₃ ผลการทดลองพบว่าที่ปริมาณ x = 0.12 เซรามิกมีความหนาแน่นในการกักเก็บ พลังงานสูงสุดที่นำกลับมาใช้ไหม่ได้ 2.01 J/cm³ ประสิทธิภาพการเก็บพลังงานสูง 80.3% (ภายใต้ สนามไฟฟ้า 310 kV/cm) ดังแสดงในภาพ 15 พร้อมกับความเสถียรของอองกันรายานอน สมบัติการกักเก็บพลังงานในช่วงความถี่ตั้งแต่ 100 Hz ถึง 1 MHz และช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -150 ถึง 300 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ เซรามิก 0.88NN-0.12BSN ยังมีความหนาแน่นของกระแสขนาดใหญ่ (~979.59 A/cm²) ความหนาแน่นกำลังงานสูงมาก (~88.16 MW/ cm³) และระยะเวลาการคาย ประจุที่ประมาณ 51 ns



ภาพ 15 (a, b) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวและคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรา มิก 0.88NN-0.12BSN โดยที่ส่วนแทรกของ (a) คือความแปรผันของ *P_{max}, P_r* และ **Δ**P ที่สนามไฟฟ้า ค่าต่างๆ (c, e) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวของเซรามิก 0.88NN-0.12BSN ภายใต้ ความถื่และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน (d, f) คุณสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก 0.88NN-0.12BSN ที่ความถื่และอุณหภูมิต่างกัน

ในปี 2020 Pang และคณะ [43] ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติการกัก เก็บพลังงานของเซรามิก NaNbO₃ โดยการเติมสารประกอบกลุ่มบิสมัส Bi ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Ni_{0.67}Ta_{0.33}) ที่ปริมาณ *x* = 0.09, 0.12, 0.15, และ 0.18 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา เลือกสารประกอบ Bi(Ni_{0.67}Ta_{0.33}) เพื่อมาปรับปรุงดังต่อไปนี้ การเติมด้วย Bi³⁺ แทนที่ Na⁺ ใน ตำแหน่ง A ของโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ จะช่วยลดอุณหภูมิการเผาผนึกของทั้งระบบและยังช่วยลด การระเหยของธาตุ Na และไอออนบวกของ Bi³⁺ มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (6s²) แบบ อิเล็กตรอนคู่เดียวที่คล้ายคลึงกันกับไอออน Pb²⁺ ซึ่งสามารถทำให้โพลาไรเซชันได้ค่าที่สูง ในระหว่าง นี้การรวมกันของออร์บิทัล 2p ของไอออน O²⁻ และออร์บิทัล 6p ของไออน Bi³⁺ สามารถช่วยทำให้ ค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (P_{max}) คงค่าที่สูงไว้ได้ นอกจากนี้ การเติมแทนทาลัมออกไซด์ (Ta₂O₅) ที่มี ช่องว่างแถบพลังงานที่สูง (4.0 eV) ช่วยลดการสูญเสียของไดอิเล็กทริกของเซรามิก นอกจากนี้ (Ni_{0.67}²⁺Ta_{0.33}⁵⁺)³⁺ ที่มีประจุและรัศมีไอออนต่างกันเมื่อถูกนำไปแทนที่ในตำแหน่ง B ของเซรามิก NaNbO₃ สามารถทำลายความเป็นระเบียบช่วงยาว สร้างสนามสุ่มในโครงสร้าง และปรับปรุงลักษณะ เฟสรีแลกเซอรเฟร์โรอิเล็กทริก นำไปสู่ค่า *P*, ลดลงและ *E*_b เพิ่มขึ้น ผลการทดลองพบว่าที่ปริมาณ *x* = 0.15 เซรามิกมีความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานที่สูงมาก 5.53 J/cm³ และประสิทธิภาพการเก็บ พลังงานสูงถึง 82% ภายใต้สนามไฟฟ้า 575 kV/cm⁻¹ (ภาพ 16) พร้อมกับความเสถียรของอุณหภูมิ และความถี่ทีดี นอกจากนี้ที่ปริมาณ *x* = 0.15 พบว่าอัตราการชาร์จ-คายประจุที่เร็วมาก (t_{0.9} = 27.5 ns) มีความหนาแน่นของกระแสขนาดใหญ่ (*C*_D = 506.42 A cm⁻²) และความหนาแน่นของกำลังงาน ที่สูงขึ้น (*P*_D = 35.45 mW cm⁻³)



ภาพ 16 (a) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวพร้อมด้วย (b) ค่า Wrec และ **η** ของเซรา มิก (1-*x*)NN-*x*BNT (*x* = 0.09, 0.12, 0.15, และ 0.18) ภายใต้สนามไฟฟ้าสูงสุดที่แต่ละปริมาณ *x* ทนได้ก่อนเบรกดาวน์ (c) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวของเซรามิก 0.85NN-0.15BNT ภายใต้สนามไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (d) *W*_{rec} และ **η** ของเซรามิก 0.85NN-0.15BNT ภายใต้สนามไฟฟ้า ต่างๆ

ในปี 2020 Shi และคณะ [7] ได้ศึกษาเซรามิกแอนติเฟร์โรอิเล็กทริกระบบ (1-x)NaNbO₃xBi(Zn_{0.5}Ti_{0.5})O₃ ที่ปริมาณ x = 0.0, 0.03, 0.06, 0.09, และ 0.12 (เรียกโดยย่อ (1-x)NN-xBZT) เพื่อพัฒนาการกักเก็บพลังงานสำหรับในเซรามิก NaNbO₃ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง โดยเผาซิน เตอร์ที่อุณหภูมิ 1180—1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าเมื่อเจือด้วย BZT วงวนฮี สเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวมีลักษณะบางลง และเมื่อเจือด้วย BZT ที่ปริมาณ x = 0.09พบว่าเซรามิกมีความหนาแน่นการกักเก็บพลังงานสูงสุด 2.1 J/cm³ (ภายใต้สนามไฟฟ้า 200 kV/cm) และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน 76% พร้อมกับความเสถียรของอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยัง พบว่ามีอัตราการชาร์จ-คายประจุที่รวดเร็ว (50 ns) ที่ปริมาณ x = 0.09 ดังแสดงในภาพ 17 (a) และ

(b)



ภาพ 17 (a) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวของเซรามิก (1-x)NN-xBZT (b) กราฟแสดง ค่า J_d และ **η** ตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของ BZT (c) วงวนฮีสเทอรีซิส (P-E loop) แบบขั้วเดียวของ เซรามิก 0.91NN-0.09BZT ภายใต้ไฟฟ้า

ในปี 2019 Ye และคณะ [17] ได้ศึกษาการเติมสารประกอบกลุ่มบิสมัส Bi ที่มีโครงสร้าง ตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Mg_{2/3}Nb_{1/3})O₃ (BMN) ลงในเซรามิกโซเดียมไนโอเบต (NaNbO₃) ด้วยวิธี ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ซึ่งการเติมไอออนในตำแหน่ง B จะส่งผลให้โพลาไรเซชันคงค้าง (remnant polarization: *P_r*) มีขนาดลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเฟสแอน ติเฟร์โรอิเล็กทริกของ NaNbO₃ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสมข้ามระหว่างออร์บิทัล (orbitals) 6s ของ Bi และออร์บิทัล (orbitals) 2p ของออกซิเจน (O) ยังช่วยทำให้ค่าโพลาไรเซชันสูงสุดที่ได้ ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันของ Mg²⁺และ Nb⁵⁺ ที่มีวาเลนต์แตกต่างกัน (non-isovalent) และมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตี (electronegativity) เฉลี่ยที่ต่ำจะสามารถสร้างสนามแบบสุ่มได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำลายความเป็นระเบียบช่วงยาว (long range order) ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีคุณสมบัติในการกักเก็บพลังงานที่ดีเยี่ยม พบว่าที่ 0.90NN-0.10BMN เซรามิกแสดงความ หนาแน่นในการกักเก็บพลังงานสูงถึง 3.4 J/cm³ และความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงานสูงสุดที่นำ กลับมาใช้ใหม่ได้ 2.8 J/cm³ และมีประสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงานสูง 82% นอกจากนี้เมื่อ ปริมาณการเติมเพิ่มขึ้นเป็น 0.85NN-0.15BMN พบว่าความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงาน (W_{total}) สูง 2.7 J/cm³ และความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงานสูง 90% ดังแสดงภาพ 18



ภาพ 18 วงวนฮีสเทอรีซิส (*P-E* loop) แบบขั้วเดียวและคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานที่สอดคล้องกัน สำหรับองค์ประกอบของ (a), (c) *x* = 0.10 และ (b), (d) 0.15 ภายใต้สนามไฟฟ้าต่างๆ

ในปี 2018 Li และคณะ [44] ได้ทำการศึกษาเซรามิก (1–x)BaTiO₃-xBi(Li_{0.5}Ta_{0.5})O₃ ที่ ปริมาณ 0.06 ≤ x ≤ 0.12 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก BaTiO₃ พบว่าที่ ปริมาณ x = 0.10 เซรามิกมีความหนาแน่นของพลังงาน ~2.2 J/ cm³ และประสิทธิภาพ (η) > 89% ภายใต้สนามไฟฟ้า 280 kV/cm⁻¹ แสดงในรูปที่ 6.5 นอกจากนี้เซรามิกยังแสดงความเสถียรทาง ความร้อนสูงถึง 160 องศาเซลเซียส ด้วยเวลาคายประจุที่รวดเร็ว (≤0.5 ms) นอกจากนี้เมื่อนำเซรา มิก BT-BLT มาประกอบเป็นตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น (multilayer capacitor: MLCC) พบว่าที่ ปริมาณ x = 0.1 มีค่า W_{total} สูงถึง 4.05 J/cm³ และ $\eta = 95.5\%$ ดังแสดงในภาพ 19 ซึ่งแสดงถึง ศักยภาพขององค์ประกอบในการกักเก็บพลังงานที่ดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไอออนของ Bi³⁺ เข้าไป ในตำแหน่ง Ba ส่งผลให้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ W_{total} และ P_{max} และลด P_r และเมื่อ เติม Bi(Li_{0.5}Ta_{0.5})O₃ พบว่า E_b สูงและ W_{total} ของทั้งเซรามิก BT-xBLT ที่เป็นองค์ประกอบเดี่ยว และ ที่เป็นเซรามิกแบบหลายชั้น (multilayer) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมากกว่าระบบที่ใช้ BaTiO₃ อื่นๆ



ภาพ 19 (a) ความต้านทานไฟฟ้าของเซรามิก BT-xBLT (b) การกระจาย Weibull ของ E_b ของเซรา มิก BT- xBLT (c) W_{total} และ η ของเซรามิก BT-xBLT (d) W_{total}, W_{rec} และ η ของเซรามิก 0.90BT-0.10BLT ที่สนามไฟฟ้าต่างๆ

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

- 1. โซเดียมคาร์บอเนต (Na₂CO₃) ความบริสุทธิ์ 99.95-100.05% ผลิตโดยบริษัท Alfa Aesar
- 2. ไนโอเบียมออกไซด์ (Nb₂O₅) ความบริสุทธิ์ 99.9% ผลิตโดยบริษัท Alfa Aesar
- 3. บิสมัทออกไซด์ (Bi₂O₃) ความบริสุทธิ์ 99.9 % ผลิตโดยบริษัท Sigma-Aldrich
- 4. ลิเทียมคาร์บอเนต (Li₂CO₃) ความบริสุทธิ์ 99% ผลิตโดยบริษัท Sigma-Aldrich
- 5. ทินออกไซด์ (SnO2) ความบริสุทธิ์ 99.9% ผลิตโดยบริษัท Alfa Aesar
- 6. แฮฟเนียมออกไซด์ (HfO2) ความบริสุทธิ์ 98% ผลิตโดยบริษัท Sigma-Aldrich
- 7. สารล<mark>ะลาย</mark>เอทานอล (etha<mark>nol solution</mark>) ความบริสุทธิ์ 9<mark>9.9</mark>%

3.2 อุปกร<mark>ณ์ที่ใช้ใน</mark>การเตรียมสาร

1. เครื่องซั่งแบบละเอียด satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr ใช้ชั่งมวลได้มากที่สุด ไม่เกิน 310 กรัม โด<mark>ย</mark>มีความละเอียด 0.001 กรัม

2. ตู้อบสารยี่ห้อ Memmert D06057 model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200 องศา เซลเซียส

- กระป๋องพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์ และมีฝาปิดสนิท
- 4. เม็ดบดย่อยทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร
- 5. เครื่องผสมแบบบดย่อยแบบลูกบอล (ball milling)
- 6. เครื่องกวนสารให้ความร้อน (hot plate with magnetic stirrer)
- 7. ช้อนตักสาร
- 8. บีกเกอร์ขนาด 500 และ 1000 ซีซี
- 9. แม่พิมพ์ (punch and die) ใช้ในการขึ้นรูปเซรามิก
- 10. กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ (aluminum foil)
- 11. ถ้วยอะลูมินา (alumina crucible) พร้อมฝาปิด
- 12. กระดาษทรายเบอร์ 240, 400, 800, 1200, 2400, และ 4000
- 12. ครกบดสารทำด้วยหินอาเกต (agate)

13. เครื่องอัดไฮโดรลิกสำหรับขึ้นรูปเซรามิก อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 kgf/cm³

14. เตาเผาสารอุณหภูมิสูงสุด 1400 องศาเซลเซียส

15. เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer) ยี่ห้อ Bruker รุ่น D2 PHASER

16. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopy : SEM) ยี่ห้อ thermo scientific

17. เครื่องวัดค่าไดอิเล็กทริก (Aligent LCR meter) รุ่น HP, 4284A

18. เครื่องวัดสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก (computer controlled modified sawyer tower circuit principle) รุ่น Premier II บริษัท Radiant Technologies Inc สหรัฐอเมริกา

19. เครื่องวัดรามานสเปกโตสโคปี (raman spectroscopy) ยี่ห้อ Renishaw Gloucestershire ประเทศอังกฤษ

20. เครื่องวัดอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี (Impedance spectroscopy) ยี่ห้อ Keysight, รุ่น 4194A

3.3 วิธีท<mark>ำก</mark>ารท<mark>ดล</mark>อง

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผงผลึก (1-x)NaNbO_{3"x}Bi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ และ (1-x)NaNbO_{3"x}Bi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃

 เริ่มจากเตรียมสารตั้งต้น ได้แก่ Na₂CO₃, Nb₂O₅, Bi₂O₃, Li₂CO₃, SnO₂ และ HfO₂ นำไป อบในเตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดความชื้น นำสารที่ไปอบในเตาอบ ออกมาแล้ว นำไปตั้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง เพื่อให้สารคายความร้อน

 2. ชั่งสารตั้งต้นตามอัตราส่วนโดยโมลที่ได้จากการคำนวณ โดยใช้วิธีการทางปริมาณสาร สัมพันธ์

 นำสารที่ได้มาทำการผสมกันในกระป๋องพลาสติกที่มีลูกบดเซอร์โคเนีย (ZrO₂) รูปทรงกลม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยเติมเอทานอลให้ท่วมสารซึ่งจะช่วยให้สารทั้งสองผสม เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นและปิดฝาให้สนิท จากนั้นจึงนำกระป๋องพลาสติกวางบนเครื่องบดย่อยแบบลูกบอล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 เมื่อครบ 24 ชั่วโมง เทสารลงบนตะแกรงลวดที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อล้างแยกของผสม ออกจากเม็ดบด แล้วจึงนำใส่ลงในบีกเกอร์สำหรับคนสารให้เข้ากันแล้วนำกระดาษฟอยล์ที่ทำการ เจาะรูมาปิดก่อนจะนำไปตั้งบนเครื่องกวนสารให้ความร้อน (hot plate magnetic stirrer) เพื่อทำ การระเหยเอทานอล โดยปรับให้ร้อนประมาณ 150 องศาเซลเซียส เมื่อทำให้เอทานอลระเหยออกจากสารไปหมดแล้ว จึงนำสารไปใส่ตู้อบโดยใช้อุณหภูมิ
 120 องศาเซลเซียส จนสารแห้ง

 6. นำสารที่แห้งแล้วมาทำการบดโดยใช้ครกบดสารที่ทำด้วยหินอาเกต (agate) จากนั้นนำผง สารที่ได้มาทำการคัดขนาด (sieving) ด้วยตะแกรงลวดสำหรับร่อนสารเพื่อให้ได้ขนาดอนุภาคที่มี ความสม่ำเสมอ

7. นำสารที่ได้ในข้อที่ 5 มาใส่ในถ้วยอะลูมินา (alumina crucible) แล้วนำไปเผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยใช้อัตราขึ้น-ลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศา เซลเซียสต่อนาที

8. หลังจากการเผาแคลไซน์แล้วนำผงผลึกที่ได้ไปทำการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผลึกและ ความบริสุทธิ์โดยใช้เครื่องกำเนิดรั<mark>งสีเอ</mark>กซ์ (X-ray diffractometer)



ภาพ 20 แผนผังขั้นตอนการเตรียมผงผลึก (1-*x*)NaNbO₃-*x*Bi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃



ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃

ทำการบดย่อยผงผลึกอีกครั้งโดยการนำผงผลึก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ (x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, และ 0.08)และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃ (x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, และ 0.10) ที่บริสุทธิ์ แต่ละองค์ประกอบมาใส่ในกระป๋องพลาสติกที่มีลูกบด (ZrO₂) รูปทรง กลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยเติมเอทานอลให้ท่วมสาร จากนั้นจึงนำกระป๋อง พลาสติกวางบนเครื่องบดย่อยแบบลูกบอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 2. เมื่อครบ 24 ชั่วโมง เทสารลงบนตะแกรงลวดที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อล้างแยกของผสม ออกจากเม็ดบด จากนั้นใส่ลงในบีกเกอร์สำหรับคนสารให้เข้ากันแล้วนำกระดาษฟอยล์ที่ทำการเจาะรู มาปิดก่อนจะนำไปตั้งบนเครื่องกวนสารให้ความร้อน (hot plate magnetic stirrer) เพื่อทำการ ระเหยเอทานอล โดยปรับให้ร้อนประมาณ 150 องศาเซลเซียส

เมื่อทำให้เอทานอลระเหยออกจากสารไปหมดแล้วจึงนำสารไปทำการอบโดยใช้อุณหภูมิ
 120 องศาเซลเซียส จนสารแห้ง

4. นำสารที่แห้งแล้วมาทำการบดโดยใช้ครกบุดสารที่ทำด้วยอาเกต จากนั้นนำผงสารที่ได้มา ผสม Polyvinyl Butyral resin (PVB) ในอัตราส่วน 1:1 ในครกบุดสาร บุดสารกับ PVB ให้เข้ากันจน แห้ง หลังจากนั้นทำการคัดขนาด (sieving) ด้วยตะแกรงลวดสำหรับร่อนสาร เพื่อให้ได้ขนาดอนุภาค ที่มีความสม่ำเสมอ

5. นำสารในข้อ 4 มาทำการอัดขึ้นรูปโดยใช้ความดันที่ 80 MPa เป็นเวลา 30 วินาที จะได้ ชิ้นงานรูปทรงกระบอก ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร

 6. นำชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วใส่ถ้วยอะลูมินาที่บรรจุผงอะลูมินาโดยให้ชิ้นงานอยู่ในผงอะลูมินา จากนั้นปิดฝาและนำไปเผาซินเตอร์ ที่อุณหภูมิรหะว่าง 1315-1250 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการ ขึ้น-ลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และเผาแช่ที่อุณหภูมิดังกล่าวเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

7. หลังจากการเผาซินเตอร์แล้วนำเม็ดเซรามิกมาตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer ;XRD) วัดความหนาแน่นของเซรามิกโดยอาศัย หลักการของอาร์คีมีดีส ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopy; SEM) ตรวจสอบการเปลี่ยนเฟสด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโค ปี (Raman spectroscopy) วัดสมบัติไดอิเล็กทริกด้วยเครื่อง LCR (ในช่วงอุณภูมิห้องถึง 450 องศา เซลเซียส) วัดสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกเพื่อนำไปคำนวณคุณสมบัติการกักเก็บพลังงาน และตรวจสอบ สมบัติการนำไฟฟ้าด้วยเทคนิคเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี (Impedance spectroscopy)



ภาพ 22 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃



ภาพ 23 แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃

3.4 การเตรียมชิ้นงานเซรามิก สำหรับวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะและสมบัติต่าง ๆ

3.4.1 การตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ (physical properties)
 3.4.1.1 ตรวจสอบความบริสุทธิ์และโครงสร้างเฟสของผงผลึกและชิ้นงานเซรามิ
 กด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction analysis; XRD)

 วิเคราะห์เฟสของผงผลึกเพื่อหาเงื่อนไขอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาแคลไซน์
 เมื่อได้ผงผลึกที่เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิที่เหมาะสม นำไปอัดขึ้นเป็นเม็ดจากนั้น นำไปเผาซินเตอร์เพื่อหาเงื่อนไขของอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของเซรามิก (1x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃

3. นำเม็ดเซรามิกที่ได้ไปขัดที่ผิวหน้าทั้งสองด้านด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150, 360 และ 600 ตามลำดับ

4. นำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการขัด ไปบดเป็นผงเพื่อ<mark>นำไปตรวจสอบโครงสร้างเฟสและ</mark> ความบริสุทธิ์ด้วยเ<mark>ทค</mark>นิคการเลี้ยวเบนขอ<mark>งรังสีเอ</mark>กซ์

 3.4.1.4 วัดความหนาแน่นของเซรามิกโดยอาศัยหลักการของอาร์คีมีดีส หลังจากขัดทำความสะอาดผิวขึ้นงานหลังเผาผนึก เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นซึ่ง สัมพันธ์กับสมบัติทางไฟฟ้า เช่น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก นำมาหาความหนาแน่นรวม มีขั้นตอนดังนี้
 1. นำชิ้นงานตัวอย่างเขียนสัญลักษณ์ด้วยดินสอที่หลังเม็ด (ป้องกันการสับสน)
 จากนั้นนำไปต้มในน้ำ (น้ำปราศจากไอออน (deionized water)) จนกว่าฟองที่อยู่บริเวณผิวของ
 ชิ้นงานจะหมดไป ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2. นำชิ้นงานตัวอย่างไปชั่งในน้ำ ได้น้ำหนักชั่งในน้ำ

3. นำชิ้นงานตั<mark>วอย่างไปอบให้แห้งสนิท แล้</mark>วปล่อยให้เย็นตัว จากนั้นนำไปซั่งได้เป็น น้ำหนักแห้ง (WD)

4. นำค่าที่ได้จากข้อ 2 ถึง 3 ไปหาค่าความหนาแน่นรวม ดังสมการต่อไปนี้

ความหนาแน่น
$$ho = rac{W_a}{W_a - W_{fl}} ullet
ho_{fl}$$

เมื่อ ho คือค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³)

 ho_{fl} คือค่าความหนาแน่นของของเหลว หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³)

*W*_a คือน้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม (g)

 W_{fl} คือน้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม (g)

3.4.1.3 ตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (scanning electron microscopy; SEM)

เพื่อใช้ยืนยันและอธิบายลักษณะของพื้นผิวของชิ้นงาน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับชิ้นงาน เช่น รูพรุน ขนาดเกรน ความหนาแน่น เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานก่อน ทดสอบดังต่อไปนี้

1. นำเม็ดเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ (x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, และ 0.08) และ (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃ (x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, และ 0.10) ไป ขัดที่ผิวหน้าด้านใดด้านหนึ่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150, 360, 600, 1000, 1200, 2400 และ 4000 ตามลำดับ เพื่อให้ผิวของเม็ดเซรามิกมีความเรียบ และเงา

 จากนั้นนำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการขัดจากกระดาษทรายมาขัดด้วยผ้าสักหลาดอีก รอบ เพื่อสร้างความเงาให้กับผิวหน้าของเม็ดเซรามิก

3. นำเม็ดเซรามิกที่ขัดจนขึ้นเงาแล้ว นำไปสั่นในเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค เพื่อกำจัด สิ่งแปลกปลอมบนผิวชิ้นงาน

4. จากนั้นนำเม็ดเซรามิกไปเผา (thermal etching) เพื่อสกัดด้วยความร้อน โดยจะ ลดอุณหภูมิลงจา<mark>กอุ</mark>ณหภูมิเผาผนึก 75 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการขึ้<mark>น-ลงของอุณหภูมิเป็น 5</mark> องศาเซลเซียสต่อนาที และแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที

5. จา<mark>กนั้นน</mark>ำเม็ดที่ผ่านการเผาสกัดผิวหน้าแล้วติดด้วยเทปกาวคาร์บอน และนำไป เคลือบผิวหน้าด้วยทองคำ เพื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างทางจุ<mark>ลภาค</mark>

3.4.2 วิเคราะห์สมบัติท<mark>างไฟฟ้าของเซรามิก</mark>

3.4.2.1 การวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริก (dielectric properties)

 การวิเคราะห์ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant) และค่าการสูญเสียไดอิ เล็กทริก (dielectric loss) โดยจะเตรียมชิ้นงานแต่ละองค์ประกอบ นำมาขัดให้มีความหนาประมาณ
 0.7 มิลลิเมตร ในทุกตัวอย่าง

2. นำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการขัดมาทำขั้วด้วยการทากาวเงิน (silver paste) ทั้งสอง ด้านของชิ้นงาน นำแอลกอฮอล์เซ็ดทำความสะอาดบริเวณขอบชิ้นงาน เพื่อป้องกันการลัดวงจร

3. นำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเผาไล่สิ่งเจือปน หรือออกไซด์ที่มากับกาวเงิน

4. นำเม็ดเซรามิกไปวัดสมบัติไดอิเล็กทริกในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25 ถึง 450 องศา เซลเซียส โดยจะใช้ความถี่ 1, 10 และ 100 kHz ด้วยเครื่อง LCR meter นำค่าที่ได้มาเขียนกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ (แกน x) กับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (แกน y)

3.4.2.2 การวิเคราะห์สมบัติการกักเก็บพลังงาน (energy storage properties)

 สำหรับการวิเคราะห์วงฮิสเทอรีซิสแบบยูนิโพลาร์ (unipolar) โดยเตรียมชิ้นงาน ที่ถูกขัดให้มีความหนาประมาณ 0.2 ถึง 0.4 มิลลิเมตร

2. เมื่อได้ความหนาของชิ้นงานที่ต้องการแล้ว นำไปทำขั้วด้วยการทากาวเงิน (silver paste) ทั้งสองด้านของชิ้นงาน และแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดบริเวณขอบชิ้นงาน

 3. นำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเผาไล่สิ่งเจือปน หรือออกไซด์ที่มากับกาวเงิน

4. นำชิ้นงานตัวอย่างใส่ในเข้าทดสอบชิ้นงานที่ถูกบรรจุด้วยน้ำมันซิลิโคนระหว่าง
 อิเล็กโทรดทั้งสอง เพื่อทดสอบชิ้นงาน โดยใช้ความถี่ที่ 10 Hz และป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นงาน
 ตัวอย่าง จนกระทั่งชิ้นงานเกิดการซ์อต โดยชิ้นงานจะถูกวัดที่อุณหภูมิห้อง

5. สำหรับการวัดความเสถียรต่ออุณหภูมิ นำชิ้นงานตัวอย่างใส่ในเบ้าทดสอบชิ้นงาน ที่ถูกบรรจุด้วยน้ำมันซิลิโคนระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสอง เพื่อทดสอบชิ้นงาน โดยโดยใช้ความถี่ที่ 10 Hz และป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นงานตัวอย่างที่เหมาะสม โดยชิ้นงานจะถูกวัดที่อุณหภูมิตั้งแต่ 25, 50, 75, 100, 125 และ 150 ตามลำดับ

้<mark>6. บันทึกผล</mark>ที่ได้ และนำวิเคราะห์สมบัติกักเก<mark>็บพลัง</mark>งา<mark>นแ</mark>ละความเสถียรต่ออุณหภูมิ

3.4.3.<mark>2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารั่</mark>วไหล (leakage current

density)

1. เตรียมชิ้นงานโดยขัดให้มีความหนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

2. นำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการขัดมาทำขั้วด้วยการทากาวเงิน (silver paste) ทั้งสอง ด้านของชิ้นงาน นำแอลกอฮอล์เซ็ดทำความสะอาดบริเวณขอบชิ้นงาน เพื่อป้องกันการลัดวงจร

 นำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเผาไล่สิ่งเจือปน หรือออกไซด์ที่มากับกาวเงิน

นำชิ้นงานตัวอย่างใส่ในเข้าทดสอบชิ้นงานที่ถูกบรรจุด้วยน้ำมันซิลิโคนระหว่าง
 อิเล็กโทรดทั้งสอง เพื่อทดสอบชิ้นงาน โดยจะป้อนกระแสไฟฟ้า 60 กิโลโวลต์ ให้กับชิ้นงานตัวอย่าง
 โดยชิ้นงานจะถูกวัดที่อุณหภูมิห้อง

5. บันทึกผลที่ได้ และนำไปวิเคราะห์ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

3.4.4.2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี (Impedance

spectroscopy)

1. เตรียมชิ้นงานที่ถูกขัดให้มีความหนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

2. นำเม็ดเซรามิกที่ผ่านการขัดมาทำขั้วด้วยการทากาวเงิน (silver paste) ทั้งสอง ด้านของชิ้นงาน นำแอลกอฮอล์เซ็คทำความสะอาดบริเวณขอบชิ้นงาน เพื่อป้องกันการลัดวงจร

 นำไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพื่อเผาไล่สิ่งเจือปน หรือออกไซด์ที่มากับกาวเงิน

4. นำชิ้นงานไปทดสอบความต้านทานโดยใช้อุณหภูมิการวัดตั้งแต่ 400 ถึง 540 องศาเซลเซียส และความถี่ในช่วง 20 Hz ถึง 10 MHz

5. บันทึกผลที่ไ<mark>ด้ และนำวิเคราะห์สมบัติกา</mark>รนำไฟฟ้า



บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการทดลองของเซรามิก NaNbO₃ ที่ถูกเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อน โดยแบ่งออกเป็นสองหัวข้อ หัวข้อแรก กลุ่ม (1x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และหัวข้อที่สอง กลุ่ม (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ที่ เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง จากนั้นนำเซรามิกทั้ง 2 ระบบไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วย เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction; XRD) วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope; SEM),วิเคราะห์โครงสร้าง เฉพาะที่ด้วยเทคนิครามานสเปกโทรสโคปี ในช่วงเลขคลื่นระหว่าง 100 ถึง 1000 cm⁻¹, สมบัติไดอิ เล็กทริกในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25 ถึง 450 องศาเซลเซียส ที่ความถี่ 1, 10 และ 100 kHz ด้วยเครื่อง LCR meter, สมบัติการกักเก็บพลังงาน (ภายใต้สนามไฟฟ้าที่แตกต่างกัน), ความเสถียรของอุณหภูมิ ในช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 150 องศาเซลเซียส, วิเคราะห์ค่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหล, และสมบัติการ นำไฟฟ้าด้วยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี (Impedance spectroscopy) โดยมีการอภิปรายผล การทดลองตามลำดับ ดังนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติกายภาพและสมบัติไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3},
 Sn_{2/3})O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

4.1.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction: XRD) ของเซรามิก *x*BLS

นำผงผลึก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Sn_{2/3})O₃ (เรียกโดยย่อว่า xBLS) ที่ปริมาณ x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.10 มาเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง นำมา อัดขึ้นรูปให้เป็นเม็ดแล้วนำไปเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1250 ถึง 1350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเซรามิก xBLS ที่ผ่านการซินเตอร์แล้วมาทำการตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 20 ในช่วง 20–80 องศา ได้ผลดังแสดงในภาพ 24(ก) โดยพบว่าเซรามิก xBLS มีโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ที่บริสุทธิ์ที่ปริมาณ 0 ≤ x ≤ 0.08 แต่ที่ปริมาณ x = 0.10 พบพีคของ เฟสแปลกปลอมปรากฏขึ้น แสดงให้เห็นว่าขีดจำกัดในการละลายของสาร BLS ในระบบเซรามิก NaNbO₃ มีค่าน้อยกว่า 10 โมลเปอร์เซนต์ เมื่อพิจารณาที่มุม 46.5° จะสังเกตเห็นพีคคู่ของระนาบ (202)/(020) อย่างชัดเจนที่ปริมาณ $0 \le x \le 0.04$ แต่เมื่อปริมาณ $x \ge 0.06$ พบว่าพีคถูกรวมเข้า เป็นพีคเดี่ยวในระนาบ (200) ดังแสดงในภาพ 24(ข) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซรามิก xBLS มีการเปลี่ยน โครงสร้างจากออร์โธรอมบิกไปเป็นโครงสร้างซูโดคิวบิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เติม Bi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ [41], Bi(Mg_{0.5}Sn_{0.5})O₃ [45], และ Bi (Zr_{0.5}Mg_{0.5})O₃ [46] ในเซรามิก NaNbO₃



ภาพ 24 รูปแบบการเลี้ยวเบ<mark>นรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก</mark> *x*BLS (*x* = 0—0.10) ที่มุม 2**0** โดยที่ (ก) 20°—80° (ข) 45°—48°

4.1.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) ของเซรามิก *x*BLS

ภาพที่ 25(ก)—(จ) แสดงโครงสร้างจุลภาคที่ผ่านการขัดแล้วกัดด้วยความร้อน (thermal etching) พร้อมกับส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรนของเซรามิก *x*BLS (*x* = 0—0.08) ที่ซิน เตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆ โดยที่ตัวอย่างในทุกปริมาณ *x* มีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงกว่า 95% ตามที่ ยืนยันโดยวิธีการของอาร์คิมิดีส ขนาดเกรนของแต่ละตัวอย่างถูกคำนวณด้วยวิธีจุดตัดเชิงเส้น (linear intercept method) พบว่าที่ปริมาณ *x* = 0 เซรามิกมีเกรนที่ค่อนข้างใหญ่และมีขนาดเกรนเฉลี่ยอยู่ ที่ 7.05 μm นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูพรุนในโครงสร้าง เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น พบว่าเซรามิกมีเกรนที่ ค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้น ไม่มีรูพรุน ขนาดเกรนเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 4.06 μm (สำหรับ x = 0.02) และเมื่อปริมาณ x = 0.04 ขนาดเกรนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก (ประมาณ 10 เท่า หรือ 1 ลำดับ ความสำคัญ) เป็น 0.78 μm ดังแสดงในภาพ 25(ค) จากนั้นขนาดเกรนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.03 μm และ 1.43 μm สำหรับ x = 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ มีการรายงานว่าขนาดเกรนเฉลี่ยมีผล อย่างมากต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก NaNbO₃ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (*E*_b) และค่ากระแสรั่วไหล (leakage current) [41,47] ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป



ภาพ 25 (ก)—(จ) ภาพ<mark>ถ่ายโครงสร้างจุลภาคของพื้นผิวเซรามิก x</mark>BLS (x = 0—0.08) ที่ถูกกัดด้วย ความร้อนพร้อมส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรน

4.1.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก xBLS

กราฟค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}_r) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan δ) ของเซรามิก xBLS (x = 0-0.08) ที่ไม่ได้ผ่านการโพลในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25–450 องศาเซลเซียส และความถี่ 1, 10, และ 100 kHz แสดงดังในภาพ 26(ก)–(จ) สำหรับเซรา มิก NaNbO₃ ที่บริสุทธิ์ พบว่าค่าไดอิเล็กทริกสูงสุด (dielectric maxima) อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 362 องศาเซลเซียส ซึ่งคืออุณหภูมิที่เซรามิก NN เปลี่ยนจากเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *P* (antiferroelectric *P* phase) เป็นเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *R* (antiferroelectric *R* phase) (เรียก โดยย่อว่า T_{P-R}) [48–50] เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นเป็น 0.02, 0.04 และ 0.06 พบว่าพีค T_{P-R} เลื่อนไปที่ อุณหภูมิต่ำโดยมีค่าเป็น 258, 175 และ 80 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ดังแสดงในภาพ 26(ข)—(ง) และตารางที่ 2 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาที่ x = 0.06 พบว่าพีคของ T_{P-R} มีลักษณะกว้างขึ้นและแบน ลง (ภาพ 26(ง)) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของรีแลกเซอร์ไดอิเล็กทริกโดยทั่วไป [51] และเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นเป็น 0.08 พบว่าพีค T_{P-R} จะเลื่อนไปที่อุณภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพ 26(จ) บ่งชื้ ว่าที่ปริมาณ x = 0.08 มีการเปลี่ยนเป็นเฟสรีแลกเซอร์แอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *R* อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้มี รายงานถึงปรากฏการณ์ที่คล้ายกันนี้ในเซรามิกระบบ NaNbO₃ อื่นๆ ด้วยเช่นกัน [9,52–55]

นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น พบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (\mathcal{E}_{m}) มีแนวโน้มลดลง เล็กน้อยจาก 1,552 (สำหรับ x = 0) เป็น 1,499 (สำหรับ x = 0.06) การลดลงของค่าคงที่ไดอิเล็กท ริกสูงสุดนี้อาจเกิดจากการลดลงของความแข็งแรงพันธะระหว่างไอออนที่ตำแหน่ง B กับออกซิเจนใน โครงสร้างออกตะฮีดรัล [45,56,57] ซึ่งเป็นผลมาจากรัศมีไอออนเฉลี่ยที่ใหญ่กว่าของ (Li_{1/3}Sn_{2/3})³⁺ ($r_{(Li, Sn})$ = 0.71 Å) ซึ่งเข้าไปแทนที่ Nb⁵⁺ (r_{Nb} ⁵⁺ = 0.64 Å) ที่เล็กกว่าในเซรามิก NaNbO₃ [58] การ เลื่อนไปที่อุณหภูมิต่ำของพีค T_{PR} ยังทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (\mathcal{E}_{i}) ที่อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก จาก 172 (สำหรับ x = 0) เป็น 323, 440, 1,075 และ 1,297 สำหรับ x = 0.02, 0.04, 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น พบว่าค่าการสูญเสียไดอิ เล็กทริก (tan d) ของเซรามิกลดลงอย่างมากจาก 0.019 (สำหรับ x = 0) ไปต่ำกว่า 0.009 ในทุกๆ ปริมาณ x ที่ทำการศึกษา ในช่วงอุณหภูมิ 25—150 องศาเซลเซียส การลดลงของ tand มีส่วนช่วยให้ ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (\mathcal{E}_{b}) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาสมบัติกักเก็บพลังงานของ เซรามิก NaNbO₃ [10]

53



ภาพ 26 (ก)—(จ) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}_{r}) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan δ) ของเซรามิก xBLS (x = 0–0.08) ที่ไม่ได้ผ่านการโพล ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25–450 องศาเซลเซียส และความถี่ 1, 10, และ 100 kHz

ตาราง 2 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนเฟส (T_{P-R}) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}_r) ค่าไดอิเล็กท ริกสูงสุด (dielectric maxima: \mathcal{E}_m) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan δ) ที่ ความถี่ 1 kHz ของเซรามิก xBLS (x = 0–0.08)

ปริมาณ (x)	Τ _{Ρ-R} (C ⁰)	\mathcal{E}_{r}	tan $\delta_{ m r}$	\mathcal{E}_{m}	tan $\delta_{\scriptscriptstyle m}$
<i>x</i> = 0	362	172	0.0192	1,552	0.1626
<i>x</i> = 0.02	258	323	0.0090	1,543	0.0273
<i>x</i> = 0.04	175	440	0.0089	1,527	0.0137
<i>x</i> = 0.06	80	1,075	0.0088	1,499	0.0042
<i>x</i> = 0.08	<25	1,297	0.0022	-	-

4.1.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกและสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก xBLS

วงวนยีสเทอรีซิสระหว่างโพลาไรเซชันและสนามไฟฟ้าแบบขั้วเดียว (unipolar *P*–*E* loops) ที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก *x*BLS (*x* = 0–0.08) ภายใต้สนามไฟฟ้าที่สูงสุดของแต่ละองค์ประกอบ แสดงดังภาพ 27(ก) พร้อมกับค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (*P*_{max}) และค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (*P*,) ที่ สอดคล้องกัน แสดงในภาพ 27(ข) และตาราง 3 สำหรับที่ปริมาณ *x* = 0 พบว่า *P*, มีค่าค่อนข้างมาก อยู่ที่ประมาณ 7.35 μ C/cm² และ *P*_{max} มีค่า 9.80 μ C/cm² การที่เซรามิกมี *P*, ที่มีค่าค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงาน (*W*_{loss}) ค่อนข้างสูงและประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (**ŋ**) ต่ำ ดังนั้น เซรามิก NaNbO₃ ที่บริสุทธิ์ จึงยังไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในด้านการกักเก็บพลังงาน แต่เมื่อเติม BLS ที่ ปริมาณ *x* = 0.02 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* เป็นแบบบาง โดย *P*, และ *P*_{max} ลดลงอย่างมาก ดังแสดงในภาพ 27(ข) และตารางที่ 3 เมื่อปริมาณ *x* เพิ่มขึ้นเป็น 0.04, 0.06, และ 0.08 พบว่า *P*, มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 1.5, 1.07, และ 1.04 μ C/cm² ตามลำดับ ในขณะ ที่ *P*_{max} เพิ่มขึ้นจาก 6.72 μ C/cm² (สำหรับ *x* = 0.04) เป็น 13.02 μ C/cm² (สำหรับ *x* = 0.06) ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเป็น 10.92 μ C/cm² (สำหรับ *x* = 0.08) การลดลงของ *P*, และการเพิ่มขึ้น ของ *P*_{max} เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยปรับปรุงสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก *x*BLS (*x* = 0–0.08) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับค่าความหนาแน่นของการเก็บพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (W_{rec}) และค่า ประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (η) ซึ่งคำนวณจากกราฟวงวนอิสเทอรีซิสได้ถูกแสดงไว้ในภาพ 27(ค) และ ตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์พบว่าเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น ค่า W_{rec} และ η จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จาก 0.052 J/cm³ และ 13% ที่ 80 kV/cm (สำหรับ x = 0.0) เป็น 0.56 J/cm³ และ 74% ที่ 120 kV/cm (สำหรับ x = 0.06) ซึ่ง W_{rec} ที่ได้มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับปริมาณการเติมอื่น เมื่อ x = 0.08พบว่า W_{rec} จะลดลงเหลือ 0.47 J/cm³ แต่ η เพิ่มขึ้นจนมีค่าสูงสุดเป็น 84% ที่ 110 kV/cm การที่ η เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากค่าการสูญเสียความหนาแน่นพลังงาน (W_{loss}) มีค่าลดต่ำลงเนื่องจากการลดลง ของค่า P_r อย่างต่อเนื่องตามปริมาณ x ที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่า η เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 2 การ ที่วงวนฮีสเทอรีซิส P-E แบบขั้วเดียวมีลักษณะแบบบาง จะส่งผลให้สมบัติการเก็บพลังงานดีขึ้นอย่าง เห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติม BLS ลงในเซรามิก NaNbO₃ สามารถเพิ่มความเป็นรีแลกเซอร์เฟร์โรอิ เล็กทริกของเซรามิกได้ [45,54,59] ซึ่งสอดคล้องเป็นอันดีกับผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกใน หัวข้อก่อนหน้า ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณ BLS เพิ่มขึ้น เซรามิกมีลักษณะของความเป็นรีแลกเซอร์ เฟร์โรอิเล็กทริกมากขึ้นโดยสังเกตได้ชัดเจนจากค่า $T_{P,R}$ ที่เลื่อนไปที่อุณหภูมิต่ำลงพร้อมกับความกว้าง ของพีค $T_{P,R}$ มีค่าเพิ่มขึ้น

้นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ BLS เพิ่มขึ้น พบว่าค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) ของเซรามิกมี ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 80 kV/cm ที่ปริมาณ x = 0 เป็น 90 kV/cm ที่ปริมาณ x = 0.02 และเพิ่มขึ้น ้อย่างเห็นได้ชัดเป็น 130 kV/cm เมื่อ x เพิ่มขึ้นเป็น 0.04 ก่อนที่จะลดลงเป็น 120 kV/cm และ 110 kV/cm สำหรับ x = 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 การที่เซรามิกสามารถทน ้สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ได้เพิ่มขึ้น หลังจากการเพิ่ม BLS มีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดเกรนที่ลดลง ตามที่ ้อธิบายไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคซึ่งพบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก (ประมาณ 10 เท่า หรือ 1 ลำดับความสำคัญ) จาก 7.05 μm (สำหรับ x = 0) เป็น 0.78 μm (สำหรับ x = 0.04) ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.43 μm (สำหรับ x = 0.08) งานวิจัยก่อนหน้านี้รายงานว่า ขนาดเกรนเฉลี่ยที่เล็กลงสามารถช่วยเพิ่มความหนาแน่นของขอบเกรน (grain boundary) ในเซรามิก ้นำไปสู่การเพิ่มขนาดพื้นที่ของบ<mark>ริเวณป</mark>ลอดพาหะ (depletion regions) ซึ่งสามารถขัดขวางการ ้เคลื่อนที่ของประจุพาห<mark>ะ (ch</mark>arge carriers) ต่างๆ ดังนั้น เซร<mark>ามิกที่</mark>มีเกรนขนาดเล็ก จึงมีค่ากระแส ้รั่วไหลและการสูญเสียไ<mark>ดอ</mark>ิเล็กทริกที่ต่ำกว่า รวมถึงค่าสนามไฟฟ้<mark>าเบรก</mark>ดาว<mark>น์ที่เพิ่มขึ้น</mark> [17,41,60] การเพิ่มขึ้นของค่า E_b เนื่องจากขนาดเก<mark>รนที่ลดลงได้ถูกรายงาน</mark>อย่างก<mark>ว้าง</mark>ขวางในการศึกษาก่อนหน้า ในเซรามิก NaNbO3 ที่ถูกทำเป็นสารล<mark>ะลายของแข็</mark>งกับสารประกอบเพอรอฟสไกต์เชิงซ้อนกลุ่ม ู้บิสมัทอื่นๆ [4<mark>5,57</mark>,61] ตัวอย่างเช่น Ma และคณะ [41] ได้ทำการศึก<mark>ษาเ</mark>ซรามิก (1-x)NaNbO₃xBi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ พบว่าการที่ขนาดเกรนลดลงจาก 8.64 μm (x = 0) เป็น 1.14 μm (x = 0.12) ้ส่งผลให้ค่า $E_{\rm b}$ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 150 kV/cm (x = 0) เป็น 310 kV/cm (x = 0.12) นอกจากนี้ ้ยังมีการราย<mark>งานผลลัพธ์ที่คล้ายกันในระบบ BaTiO₃-xBi(Mg_{1/2}Hf_{1/2})O₃ [6<mark>2</mark>] ผลลัพธ์ที่ได้เหล่านี้</mark> ้ ชี้ให้เห็นว่าทั้งข<mark>นาดเกร<mark>นที่เล็กลงและคว</mark>ามเป็นรีแล<mark>กเซอร์ที่เพิ่มขึ้นห</mark>ลังจากก<mark>า</mark>รเติม BLS สามารถช่วย</mark> ในการพัฒนาและปรับปรุงค่า E_b, W_{rec} และ **ๆ** ในระบบเซรามิก NaNbO₃ [41,45]


ภาพ 27 (ก) กราฟวงวนฮีสเทอรีซิส (*P*—*E* loop) แบบขั้วเดียว (ข) ค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (P_{max}) และ ค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (*P_r*) และ (ค) ความหนาแน่นของการกักเก็บพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (*W*_{rec}) และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (η) ของเซรามิก *x*BLS (*x* = 0—0.08)

ปริมาณ (x)	P _r	P _{max}	Eapplied	W	W _{rec}	W _{loos}	η
	(μC/cm²)	(µC/cm²)	(kV/cm)	(J/cm ³)	(J/cm³)	(J/cm³)	(%)
<i>x</i> = 0	7.35	9.80	80	0.40	0.052	0.35	13
<i>x</i> = 0.02	1.48	4.30	90	0.23	0.089	0.14	39
<i>x</i> = 0.04	1.50	6.72	130	0.45	0.31	0.14	68
<i>x</i> = 0.06	1.07	13.02	120	0.76	0.56	0.2	74
<i>x</i> = 0.08	1.04	10.92	110	0.56	0.47	0.09	84

ตาราง 3 พารามิเต<mark>อร์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติการเก็บพลังงานของเซรา</mark>มิก *x*BLS (*x* = 0–0.08)

4.1.5 ผลการวิเคราะห์ความเสถียรของอุณหภูมิของเซรามิก 0.06BLS

ความเสถียรต่ออุณหภูมิของค่า *W*_{rec} และ **η** เป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้อง พิจารณาเมื่อต้องการนำวัสดุไดอิเล็กทริกไปใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานในทางปฏิบัติ ดังนั้นเซรามิก *x*BLS ที่ปริมาณ *x* = 0.06 ซึ่งมีค่า *W*_{rec} สูงสุดและมี **η** มากกว่า 70 % จึงถูกนำมาวิเคราะห์ความ เสถียรต่ออุณหภูมิ โดยเซรามิกจะถูกวัดตรวจสอบสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิต่างๆ กันตั้งแต่ 25 ถึง 100 องศาเซลเซียส ภายใต้สนามไฟฟ้า 80 kV/cm ดังแสดงในภาพ 27(ก) ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ ชัดเจนว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น วงวนฮีสเทอรีซิสจะมีลัษณะแคบลงโดยมีค่า *P*_{max} ลดลงเล็กน้อยจาก 12.29 µC/cm² (ที่ 25 องศาเซลเซียส) เป็น 9.77 µC/cm² (ที่ 100 องศาเซลเซียส) ในขณะที่ค่า *P*_r มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อนำวงวนฮิสเทอรีซิส *P-E* ในแต่ละอุณหภูมิมาคำนวณ ค่า *W*_{rec} และ **η** ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในภาพ 28(ข) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น พบว่าค่า *W*_{rec} ลดลงเล็กน้อย จาก 0.38 J/cm³ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น 0.32 J/cm³ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 15% ในทางกลับกัน **ท** เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 73% (ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) เป็น 86% (ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส) ซึ่งเกิดจากการลดลงของ *P*_r ผลการทดลองนี้บ่งชี้ว่าเซรามิก *x*BLS แสดงสมบัติการกักเก็บพลังงานที่ค่อนข้างเสถียรกับอุณหภูมิ เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริกสำหรับการกักเก็บพลังงานที่ค่อนงูมิสูง [52,63,64]



ภาพ 28 (ก) วงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* ที่ปริมาณ *x* = 0.06 ภายใต้สนามไฟฟ้า 80 kV/cm ในช่วง อุณหภูมิ 25—100 องศาเซลเซียส (ข) ค่า *W*_{rec} และ η ของเซรามิก 0.06BLS ที่อุณหภูมิต่างๆ

4.1.6 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหล (leakage current density) ของ เซรามิก *x*BLS

ความหนาแน่นของกระแสรั่วไหลเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของวัสดุไดอิเล็กท ริกและวัสดุกักเก็บพลังงานเมื่อใช้งานจริงภายใต้สนามไฟฟ้าสูง กราฟความหนาแน่นกระแสรั่วไหลที่ เป็นฟังก์ชันกับเวลาของเซรามิก xBLS (x = 0-0.08) ภายใต้สนามไฟฟ้า 60 kV/cm ที่อุณหภูมิห้อง แสดงดังภาพ 29 จากภาพพบว่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหลลดลงอย่างต่อเนื่องจาก x = 0 ถึง x =0.02 ก่อนถึงจุดต่ำสุดที่ปริมาณ x = 0.04 เมื่อปริมาณ BLS เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.06 ความหนาแน่นของ กระแสไฟฟ้ารั่วไหลจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นดังแสดงในภาพ 29 ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับผลลัพธ์ E_b ที่ กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระแสรั่วไหลที่ลดลงสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่า E_b ผลลัพธ์ที่ สังเกตได้ยังแสดงให้เห็นว่าขนาดเกรนที่เล็กลงอาจส่งผลให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ลดลง สามารถนำไปสู่การเพิ่มของค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) เมื่อเซรามิกอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าสูง



ภาพ 29 ความหนาแน่นกระแสรั่วไหลวัดที่อุณหภูมิห้องภายใต้สนามไฟฟ้า 60 kV/cm ของเซรามิก xBLS (x = 0—0.08)

4.2 ผลการวิเคราะห์สมบัติกายภาพและสมบัติไฟฟ้าของเซรามิก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

4.2.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction technique: XRD)

ผงผลึก (1-x)NaNbO₃-xBi(Li_{1/3}, Hf_{2/3})O₃ (เรียกโดยย่อว่า xBLH) ที่ปริมาณ x = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10 และ 0.12 ผ่านกระบวนการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 5 ชั่วโมง นำมาอัดขึ้นรูปให้เป็นเม็ดแล้วนำไปเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1250 ถึง 1350 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนำเซรามิก xBLH ที่ผ่านการซินเตอร์แล้วมาทำการตรวจสอบ โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 20 ในช่วง 20—80 องศา ได้ผลดังแสดงในภาพ 30(ก) พบว่าเซรามิก xBLH มีโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ที่บริสุทธิ์ที่ปริมาณ $0 \le x \le 0.10$ แต่เมื่อ ปริมาณ x = 0.12 พบเฟสแปลกปลอมปรากฏขึ้น แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดในการละลายของสาร BLH ในระบบเซรามิก NaNbO₃ เมื่อพิจารณาที่มุม 46.5 องศา จะสังเกตเห็นพีคคู่ในระนาบ (202)/(020) อย่างชัดเจนที่ปริมาณ $0 \le x \le 0.02$ เมื่อปริมาณ $x \ge 0.04$ พบว่าพีคถูกรวมเข้าเป็นพีคเดี่ยวใน ระนาบ (200) ดังแสดงในภาพ 30(ข) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซรามิก xBLH มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผลึกจากออร์โธรอมบิกไปเป็นซูโดคิวบิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าของระบบเซรามิก NaNbO₃ ที่ถูกเติมด้วย Bi(Mg_{0.5}Hf_{0.5})O₃ [68], Bi(Mg_{2/3}Ta_{1/3})O₃ [69], และ Bi(Mg_{2/3}Nb_{1/3})O₃ [17]



ภาพ 30 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.12) ที่มุม 20 (ก) 20°—80° (ข) 45°—48°

4.2.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) ของเซรามิก xBLH

ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของเซรามิก *x*BLH (x = 0-0.10) ที่ผ่านการขัดเงาแล้วกัดผิวหน้าด้วยความร้อน (thermal etching) พร้อมกับส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรนของเซรามิก *x*BLH แสดงดังในภาพ 31(ก)–(ฉ) ตัวอย่างทั้งหมดแสดงโครงสร้างจุลภาคที่หนาแน่นและมีความพรุนต่ำ จากนั้นคำนวณขนาดเกรนของ แต่ละตัวอย่างโดยใช้วิธีจุดตัดเชิงเส้น พบว่าที่ปริมาณ x = 0 เซรามิกมีเกรนที่ค่อนข้างใหญ่และมี ขนาดเกรนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.05 μ m นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูพรุน เมื่อปริมาณ BLH เพิ่มขึ้น พบว่าเซรามิกมี เกรนที่ค่อนข้างใหญ่และมี ขนาดเกรนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.05 μ m นอกจากนี้ยังพบว่ามีรูพรุน เมื่อปริมาณ BLH เพิ่มขึ้น พบว่าเซรามิกมี เกรนที่ค่อนข้างใหญ่และมี 1 ลำดับความสำคัญ) จาก 7.05 μ m (x = 0) เป็น 0.96 μ m (x = 0.08) ดังแสดงในภาพ 31(จ) จากนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.36 μ m (x = 0.10) มีการรายงานว่าขนาดเกรนเฉลี่ยมีผลอย่างมากต่อ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก NaNbO₃ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) และ กระแสไฟฟ้ารั่วไหล [41,47] ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้อถังไป

ในการศึกษานี้พบว่าความหนาแน่นต่ำสุดของเซรามิกที่เตรียมได้มีค่า 4.38 g/cm³ เมื่อนำมา คำนวณค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์โดยเทียบกับความหนาแน่นตามทฤษฎีของเซรามิก NaNbO₃ บริสุทธิ์ (4.55 g/cm³ [70]) พบว่ามีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 96% ในทุกตัวอย่าง ความหนาแน่น สัมพัทธ์ที่สูงนี้บ่งชี<mark>้ว่าเซรามิกที่เ</mark>ตรียมได้ทั้งหมดมีคุณภาพดี [71]



ภาพ 31 (ก)—(ฉ) ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10) ที่ถูกกัดด้วยความ ร้อนพร้อมส่วนแทรกที่แสดงการกระจายขนาดเกรน

4.2.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก xBLH

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan \mathcal{O} ของเซรามิก xBLH (x = 0–0.10) ที่ไม่ได้ผ่านการโพลในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 30–450 องศาเซลเซียส และความถี่ 1, 10, และ 100 kHz แสดงดังในภาพ 32(ก)–(ฉ) สำหรับเซรา มิก NaNbO₃ ที่บริสุทธิ์ แสดงค่าไดอิเล็กทริกสูงสุด (dielectric maxima) ที่อุณหภูมิประมาณ 362 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมินี้แสดงถึงอุณหภูมิที่เซรามิกเกิดการเปลี่ยนเฟสจากเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กท ริก *P* (antiferroelectric *P* phase) ไปยังเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *R* (antiferroelectric *R* phase) (เรียกโดยย่อว่า *T*_{P-R}) [48–50] เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นเป็น 0.02, 0.04 และ 0.06 พบว่าพีค *T*_{P-R} เลื่อนไปที่อุณหภูมิต่ำเป็น 225, 163, และ 75 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ดังแสดงในภาพ 32 (ข)–(ง) และตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาที่ x = 0.06 พีคของ *T*_{P-R} แสดงพีคที่กว้างขึ้นและขึ้นกับความถี่ ดังแสดงในภาพ 32(ง) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของรีแลกเซอร์ไดอิเล็กทริกโดยทั่วไป [51] และเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นเป็น 0.08 และ 0.10 พบว่าพีคของ *T*_{P-R} เสื่อนไปต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพ 32 (จ)–(ฉ) บ่งซื้ว่าเซรามิก xBLH ที่ปริมาณ x ≥ 0.08 เปลี่ยนเป็นเฟสรีแลกเซอร์แอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *R* อย่างสมบูรณ์ พบปรากฏการณ์ที่คล้ายกันนี้ในเซรามิกระบบ NaNbO₃ อื่นๆ เช่นเดียวกัน [9,52– 55]

การที่พีค $T_{P,R}$ เลื่อนไปที่อุณหภูมิต่ำ อาจเกิดจากความแข็งแรงของพันธะระหว่างไอออนที่ ตำแหน่ง B กับออกซิเจนในโครงสร้างออกตะฮีดรัลลดลง [45,56,57] ซึ่งเป็นผลจากรัศมีไอออนเฉลี่ย ที่ใหญ่กว่าของ (Li_{1/3}Hf_{2/3})³⁺ (r_{(Li, H0}= 0.72 Å) ที่เข้าไปแทนที่ Nb⁵⁺ (r_{Nb}⁵⁺ = 0.64 Å) ที่เล็กกว่าใน เซรามิก NaNbO₃ [48] นอกจากนี้การเลื่อนไปที่อุณภูมิต่ำของพีค $T_{P,R}$ ยังทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (\mathcal{E}) ที่อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 172 ที่ปริมาณ x = 0 เป็น 1,601 ที่ปริมาณ x = 0.08ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเป็น 1,109 ที่ปริมาณ x = 0.10 เนื่องจากพีค $T_{P,R}$ เลื่อนไปต่ำกว่า อุณหภูมิห้องมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 สำหรับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (maximum dielectric constant : \mathcal{E}_m) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1,552 (สำหรับ x = 0) เป็น 2,020 (สำหรับ x = 0.04) นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น พบว่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (tan \mathcal{E}) ที่อุณภูมิห้องจะค่อยๆ ลดลงจาก 0.019 (สำหรับ x = 0) เป็น 0.0058 (สำหรับ x = 0.10) ดังแสดงในตารางที่ 4 การลดลงของ tan \mathcal{E} มีส่วน ช่วยให้ค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (\mathcal{E}_b) เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงคุณสมบัติกักเก็บ พลังงานของเซรามิก NaNbO₃ [10]



ภาพ 32 (ก)–(ฉ) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : *E*) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan*ð*) ของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0–0.10) ที่ไม่ได้ผ่านการโพล ในช่วงอุณหภูมิ ตั้งแต่ 30–450 องศาเซลเซียส และความถี่ 1, 10, และ 100 kHz

ตาราง 4 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนเฟส (T_{P-R}) ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (dielectric constant : \mathcal{E}_r) ค่าไดอิเล็กท ริกสูงสุด (dielectric maxima: \mathcal{E}_m) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss : tan δ) ที่ ความถี่ 1 kHz ของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10)

ปริมาณ (x)	Τ _{Ρ-R} (C ⁰)	<i>E</i> r	tan $\delta_{ ext{r}}$	\mathcal{E}_{m}	tan $\delta_{\scriptscriptstyle m}$
<i>x</i> = 0	362	172	0.0192	1,552	0.1626
<i>x</i> = 0.02	225	358	0.0185	1,956	0.0220
<i>x</i> = 0.04	163	546	0.0171	2,020	0.0066
x = 0.06	75	1,466	0.0135	1,859	0.0061
x = 0.08	<25	1,601	0.0094		-
x = 0.10	<25	1,109	0.0058		-

4.2.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างโดยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี (raman spectroscopy) ของเซรามิก *x*BLH

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงเฟสในเชรามิก xBLH ตามการแปรค่า x เทคนิครามานสเปกโทรส โคปีซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์การบิดเบี้ยวเฉพาะที่ (local distortion) ของโครงสร้างผลึก จึงถูกนำมาใช้ศึกษาเซรามิก xBLH (x = 0—0.10) ในทุกตัวอย่าง โดยสเปคตรัมรามานที่อุณหภูมิห้อง ในช่วงเลขคลื่น (wave numbers) ระหว่าง 100 ถึง 1000 cm⁻¹ แสดงดังในภาพ 33 จากภาพพบว่า สเปคตรัมรามานที่บริเวณเลขคลื่นต่ำกว่า 300 cm⁻¹ ของตัวอย่างที่ปริมาณ 0 $\leq x \leq 0.04$ แสดงพี ครามานจำนวนหลายพีค ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *P* ที่เกิดขึ้นจากการบิด เอียง (tilting) ที่ซับซ้อนของออกตะฮีดรัล NbO₆ ร่วมกับการเลื่อนของไอออน Nb จากตำแหน่งสมดุล ด้วยขนาดการกระจัดที่มาก ส่งผลให้ความยาวของแต่ละพันธะ Nb-O ในโครงข่ายออกตะฮีดรัล BO₆ มีความแตกต่างกันมาก เมื่อปริมาณ x = 0.06 พบว่าพีครามานเหล่านั้นบางส่วนจะค่อยๆ หายไปหรือ รวมเข้าด้วยกัน บ่งชี้ถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *P* และ *R* และเมื่อปริมาณ x ≥ 0.08 พบว่าพีครามานเกิดการซ้อนทับและรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในภาพ 33 ซึ่งเป็น ผลจากความแตกต่างของความยาวพันธะ Nb-O ในโครงสร้างออกตะฮีดรัล NbO₆ ของเฟสแอนติเฟร์ โรอิเล็กทริก *R* มีค่าลดลง ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับสมบัติของไดอิเล็กทริกที่รายงานในการทดลอง ก่อนหน้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ปริมาณ $x \geq 0.08$ เชรามิกถูกครอบครองโดยเฟสแอนติเฟร์โรอิเล็กทริก R อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ความกว้างของพีคที่เพิ่มขึ้นที่บริเวณเลขคลื่นประมาณ 250 cm⁻¹ และ 600 cm⁻¹ ที่ปริมาณ x ≥ 0.08 บ่งซี้ถึงพฤติกรรมความเป็นรีแลกเซอร์ไดอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้นของเซรา มิก NaNbO₃ เมื่อถูกเติมด้วย BLH ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างดีกับการศึกษาก่อน หน้านี้ที่เติม Bi(Mg_{0.5}Hf_{0.5})O₃ [68], และ Bi(Ni_{0.5}Sn_{0.5})O₃ [72] ในเซรามิก NaNbO₃



ภาพ 33 สเปกตรัมรามานที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10)

4.2.5 ผลการวิเคราะห์สมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกและสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก *x*BLH

วงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* แบบขั้วเดียว (unipolar *P-E* loops) ที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก *x*BLH (x = 0-0.10) ภายใต้สนามไฟฟ้าที่สูงสุดของแต่ละองค์ประกอบ แสดงดังในภาพ 34(ก) พร้อม กับค่าโพลาไรเซชันสูงสุด (P_{max}) และค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (P_r) ที่สอดคล้องกัน แสดงดังในภาพ 26(ข) สำหรับที่ปริมาณ x = 0 พบว่า P_r มีค่าค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณ 4.93 µC/cm² และ P_{max} อยู่ที่ 7.36 µC/cm² การที่เซรามิกมี P_r ที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงาน (W_{loss}) ค่อนข้างสูง และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (η) ต่ำ ดังนั้นเซรามิก NaNbO₃ ที่บริสุทธิ์ จึงยังไม่เหมาะที่จะ นำไปใช้ในด้านการกักเก็บพลังงาน เมื่อเซรามิกถูกเติมด้วย BLH ที่ปริมาณ x = 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 และ 0.10 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวงวนฮีสเทอรีซิส P-E เป็นแบบบาง พร้อมด้วยการลดลง อย่างมากของ P_r เกือบจะใกล้ศูนย์ที่ปริมาณ $x \ge 0.08$ ดังแสดงในภาพ 34(ข) และตารางที่ 2 ในขณะ ที่ P_{max} เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4.83 µC/cm² (สำหรับ x = 0.02) เป็น 13.54 µC/cm² (สำหรับ x = 0.08) ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเป็น 9.43 µC/cm² (สำหรับ x = 0.10) การลดลงของ P_r และการ

เพิ่มขึ้นของ P_{max} เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงสมบัติการกักเก็บพลังงานของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับค่าความหนาแน่นของการเก็บพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (W_{rec}) และค่า ประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (**η**) แสดงในภาพ 34(ค) และ ตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์พบว่าค่า W_{rec} และ **ท** จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 0.03 J/cm³ และ 8% ที่ 100 kV/cm (สำหรับ x = 0.0) เป็น 0.85 J/cm³ และ 78% ที่ 165 kV/cm (สำหรับ x = 0.08) ซึ่งค่า W_{rec} ที่คำนวณได้มีค่าสูงสุดเมื่อ เทียบกับทุกปริมาณการเติมที่ทำการศึกษา ดังแสดงในภาพ 34(ค) และตารางที่ 5 และเมื่อปริมาณ x = 0.10 พบว่า W_{rec} จะลดลงเหลือ 0.61 J/cm³ แต่กลับพบว่า **ท** กลับเพิ่มขึ้นเป็น 94% ที่ 140 kV/cm การที่ **ท** เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 5 การที่วงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* แบบขั้วเดียว มีลักษณะบางและแคบลง จะส่งผลให้สมบัติการเก็บพลังงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติม BLH ลงในเซรามิก NaNbO₃ สามารถเพิ่มลักษณะการผ่อนคลายของเซรามิกได้ [45,54,59] ผลลัพธ์ เหล่านี้สอดคล้องกับสมบัติของไดอิเลีกทริก ซึ่งแสดงความเป็นรีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้น สังเกตได้จากการเลื่อนของพีค T_{P-R} ไปที่อุณหภูมิต่ำลงและความกว้างของพีค T_{P-R} ที่เพิ่มขึ้น เมื่อ ปริมาณ BLH เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ xBLH เพิ่มขึ้น พบว่าค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) ของเซรามิกมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 100 kV/cm ที่ปริมาณ x = 0 เป็น 165 kV/cm ที่ปริมาณ x = 0.08 ก่อนที่จะ ลดลงเป็น 140 kV/cm (สำหรับ x = 0.10) ดังแสดงในตารางที่ 5 การที่เซรามิกสามารถทน สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ได้เพิ่มขึ้น หลังจากการเพิ่ม BLH มีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดเกรนที่ลดลง ตามที่ อธิบายไว้ในหัวข้อการวิเคราะห์เกรน ซึ่งพบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก (ประมาณ 10 เท่า หรือ 1 ถำดับขนาด) จาก 7.05 µm (สำหรับ x = 0) เป็น 0.96 µm (สำหรับ x = 0.08) ก่อนที่จะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.36 µm (สำหรับ x = 0.10) ซึ่งสอดคล้องกับค่า E_b ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 100 kV/cm (สำหรับ x = 0) เป็น 165 kV/cm (สำหรับ x = 0.08) ซึ่งในงานวิจัยก่อนหน้านี้รายงาน ว่าขนาดเกรนเฉลี่ยที่เล็กลงสามารถช่วยเพิ่มความหนาแน่นของความหนาแน่นของขอบเกรน (grain boundary) ในเซรามิก ซึ่งนำไปสู่บริเวณปลอดพาหะที่ใหญ่ขึ้น (depletion regions) สามารถ ขัดขวางการเคลื่อนที่ของประจุอิสระต่างๆ ดังนั้น เมื่อเทียบกับเซรามิกที่มีเกรนขนาดใหญ่ เซรามิกที่มี เกรนขนาดเล็ก จะมีค่ากระแสรั่วไหลและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ต่ำกว่า และมีค่าสนามไฟฟ้า เบรกดาวน์ที่เพิ่มขึ้น [17,41,60] โดยค่า E_b เพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดเกรนที่ลดลงถูกรายงานอย่าง กว้างขวางในการศึกษาก่อนหน้านี้ในเซรามิก NaNbO₃ ที่ถูกปรับปรุงด้วยสารประกอบเพอรอฟสไกต์ บิสมัทเซิงซ้อนกลุ่มต่างๆ [45,57,61] ตัวอย่างเช่น Ma และคณะ [41] ได้ทำการศึกษาเซรามิก (1x)NaNbO₃-xBi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ พบว่าขนาดเกรนลดลงจาก 8.64 µm (สำหรับ x = 0) เป็น 1.14 µm (สำหรับ x = 0.12) พบว่าทำให้ค่า E_b เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 150 kV/cm (สำหรับ x = 0) เป็น 310 kV/cm (สำหรับ x = 0.12) ในทำนองเดียวกัน shi และคณะ [73] ได้ทำการศึกษาเซรามิก (1x)NaNbO₃-xBi(Zn_{0.5}Zr_{0.5})O₃ พบว่าขนาดเกรนลดลงจาก 4.82 µm (สำหรับ x = 0) เป็น 2.12 µm (สำหรับ x = 0.12) พบว่าทำให้ค่า E_b เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 140 kV/cm (สำหรับ x = 0) เป็น 353 kV/cm (สำหรับ x = 0.12) นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลลัพธ์ที่คล้ายกันในระบบเซรามิก BaTiO₃xBi(Mg_{1/2}Hf_{1/2})O₃ [62] ผลลัพธ์ที่ได้เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าทั้งขนาดเกรนที่เล็กลงและความเป็นรีแลกเซอร์ ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเติม BLH มศักยภาพที่ดีในการพัฒนาและปรับปรุงค่า E_b , W_{rec} และ **η** ในระบบ เซรามิก NaNbO₃ [41,45]



ภาพ 34 (ก) วงวนฮีสเทอรีซิส (*P*—*E* loop) ภายใต้สนามไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละปริมาณ x (ข) ค่าโพลา ไรเซชันสูงสุด (*P*_{max}) และค่าโพลาไรเซชันคงค้าง (*P*_r) และ (ค) ค่าความหนาแน่นของการกักเก็บ พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (*W*_{rec}) และประสิทธิภาพการเก็บพลังงาน (*η*) ของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10)

ปริมาณ (x)	P _r	P_{\max}	E applied	W	W _{rec}	W _{loss}	η
	(μC/cm²)	(μC/cm²)	(kV/cm)	(J/cm³)	(J/cm³)	(J/cm³)	(%)
<i>x</i> = 0	4.93	7.36	100	0.39	0.03	0.36	8
<i>x</i> = 0.02	1.56	4.82	110	0.29	0.12	0.17	41
<i>x</i> = 0.04	1.43	7.80	120	0.52	0.27	0.25	52
<i>x</i> = 0.06	1.38	8.45	130	0.60	0.36	0.24	60
<i>x</i> = 0.08	0.69	13.54	165	1.08	0.85	0.23	78
<i>x</i> = 0.10	0.25	9.43	140	0.65	0.61	0.04	94

ตาราง 5 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติการเก็บพลังงานของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0–0.10)

4.2.6 ผ<mark>ลกา</mark>รวิเคราะห์ความเสถียรต่ออุณหภูมิของเซรามิก 0.08<mark>BL</mark>H

ความเสถียรต่ออุณหภูมิของค่า $W_{\rm rec}$ และ **ท** เป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้อง พิจารณาเมื่อต้องการนำวัสคุไดอิเล็กทริกไปใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานในทางปฏิบัติ ดังนั้นเชรามิก xBLH ที่ปริมาณ x = 0.08 ซึ่งมีค่า $W_{\rm rec}$ สูงที่สุดและมี **ท** มากกว่า 75 % จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะนำมา ทดสอบเกี่ยวกับความเสถียรของอุณหภูมิ โดยเซรามิกจะถูกวัดที่อุณหภูมิต่างๆ กันตั้งแต่ 25 ถึง 150 องศาเซลเซียส ภายใต้สนามไฟฟ้า 90 kV/cm ดังแสดงในภาพ 35(ก) ซึ่งจากภาพจะเห็นได้ชัดเจนว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น วงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* จะแคบลงโดยค่า $P_{\rm max}$ จะค่อย ๆ ลดลงจาก 12.31 μ C/cm² (ที่ 25 องศาเซลเซียส) เป็น 11.94, 11.46, 10.99, 10.56, และ 10.30 μ C/cm² (ที่ อุณหภูมิ 50, 75, 100, 125, และ 150 องศาเซลเซียส ตามลำดับ) และ *P*, ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 1.98 μ C/cm² ที่ 25 องศาเซลเซียส เป็น 1.54, 1.34, 1.21, 1.18, และ 1.14 μ C/cm² ที่อุณหภูมิ 50, 75, 100, 125, และ 150 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยค่า $W_{\rm rec}$ และ **ท** ที่คำนวณได้จากวงวน อิสเทอรีซิส *P-E* ในแต่ละอุณหภูมิถูกแสดงไว้ในภาพ 35(ข) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น พบว่าค่า $W_{\rm rec}$ มีค่า ใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ประมาณ 0.40 *J*/cm³ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 0.39 *J*/cm³ ที่ 150 องศาเซลเซียส ในทางกลับกัน **ท** เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 75% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น 86% ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากการลดลงขอ*P*, ดังแสดงในภาพ 35(ข) ผลการ ทดลองนี้บ่งชี้ว่าเซรามิก xBLH แสดงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงานที่ค่อนข้างเสถียรกับอุณหภูมิ เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวเก็บประจุไดอิเล็กทริกสำหรับการกักเก็บพลังงานที่อุณหภูมิสูง [52,63,64]



ภาพ 35 (ก) วงวนฮีสเทอรีซิส *P-E* ที่ปริมาณ × = 0.08 ภายใต้สนามไฟฟ้า 90 kV/cm ที่ช่วงอุณหภูมิ 25—150 องศาเซ<mark>ลเซี</mark>ยส (ข) ค่า W_{rec} แ<mark>ละ ๆ ของเซรา</mark>มิก 0.08BLH ที่อุณหภูมิต่างๆ

4.2.7 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหล (leakage current density) ของ เซรามิก xBLH

ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมักใช้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของวัสดุไดอิเล็กทริก และวัสดุกักเก็บพลังงานเมื่อใช้งานภายใต้สนามไฟฟ้าสูง ความหนาแน่นกระแสรั่วไหลของเซรามิก xBLH (x = 0-0.10) ภายใต้สนามไฟฟ้าที่ใช้ 60 kV/cm ที่อุณหภูมิห้องดังแสดงในภาพ 36 จากภาพ สังเกตได้ว่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหลลดลงอย่างต่อเนื่องจาก x = 0 ถึง x = 0.06 ก่อนถึงจุดต่ำสุด ที่ปริมาณ x = 0.08 เมื่อปริมาณ BLH เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.10 ความหนาแน่นของกระแสรั่วไหลจะ ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพ 36 ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับผลลัพธ์ E_b ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ากระแสรั่วไหลที่ลดลงสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่า E_b ผลลัพธ์ที่ได้ยังชี้ให้เห็นว่าขนาดเกรน ที่เล็กลงส่งผลให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลดลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความทนทานของค่า สนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) เมื่อเซรามิกอยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าสูง [65–67]



ภาพ 36 ความหนา<mark>แน่</mark>นกระแสรั่วไหลวัดที่อุณหภูมิห้องภายใต้สนามไฟฟ้า 60 kV/cm ของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10)

4.2.8 ผลการวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้าในเซรามิก xBLH โดยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโท รสโคปี (Impedance spectroscopy)

เพื่อศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการเติม BLH ที่มีต่อสมบัติการนำไฟฟ้าของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0–0.10 จึงทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 460 ถึง 540 องศาเซลเซียส และความถี่ 20 Hz–1 MHz โดยกราฟอิมพีแดนซ์เชิงซ้อน (impedance complex-plane plot: Z*) ระหว่างค่าอิมพีแดนซ์จริง (Z') และค่าอิมพีแดนซ์จินตภาพ (Z'') พร้อม ด้วยส่วนแทรกแสดงกราฟนอร์มาไลซ์ Z''/Z'_{max} ที่เป็นฟังก์ชันกับความถี่ (*f*) ของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0, 0.04, และ 0.08) แสดงดังในภาพ 37(n)–(ค) จากภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น กราฟ อิมพีแดนซ์เชิงซ้อนในทุกตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แสดงส่วนโค้งของครึ่งวงกลมเพียง บางส่วน (ไม่เต็มวง) กลายเป็นครึ่งวงกลมสมบูรณ์และมีขนาดเล็กลง ลักษณะที่พบสอดคล้องกับ กราฟสเปกโทรสโกปิก ซึ่งพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น พีคเดอบาย (debye peak) เลื่อนตำแหน่งไปที่ ความถี่สูงขึ้น ผลลัพธ์ที่สังเกตได้เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าเซรามิก *x*BLH มีความต้านทานลดลงตาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวต้านทานประเภทค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ (negative temperature coefficient of resistance: NTCR) ที่พบได้ทั่วไปในสารกึ่งตัวนำ โดย

ความต้านทานที่ลดลงเกิดจากการที่พาหะประจุไฟฟ้า (charge carrier) ถูกกระตุ้นด้วยความร้อนจึง นำไฟฟ้าได้มากขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น [74]

เมื่อพิจารณาผลของการเติม BLH พบว่าที่ปริมาณ x = 0 กราฟอิมพีแดนซ์เชิงซ้อนมี ลักษณะเป็นครึ่งวงกลมที่ไม่สมมาตร สอดคล้องกับลักษณะของพีคเดอบายที่มีค่าความกว้างที่ครึ่งของ ความสูงพีค (Full width half maximum: FWHM) ค่อนข้างกว้าง (ภาพ 37(ก)) บ่งชี้ว่าโครงสร้าง จุลภาคเชิงไฟฟ้าเป็นแบบวิวิธพันธ์ (heterogeneous electrical microstructure) ที่มีหลาย องค์ประกอบอยู่ร่วมกัน เมื่อปริมาณ BLH เพิ่มขึ้นเป็น 0.04 และ 0.08 พบว่ากราฟอิมพีแดนซ์ เชิงซ้อนมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมเดี่ยวที่มีความสมมาตรมากขึ้น และมีพีคเดอบายมีค่า FWHM ลดลง (ภาพ 37(ข)–(ค)) บ่งชี้ว่าการเติมด้วย BLH สามารถทำให้เซรามิกที่มีความไม่เป็นเนื้อเดียวกันทาง ไฟฟ้า (electrically heterogeneous microstructure) มีความเป็นเนื้อเดียวกันทางไฟฟ้า (electrically homogeneous microstructure) เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การเติมด้วย BLH ที่ ปริมาณ x = 0.04ส่งผลให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในทุกอุณหภูมิเมื่อเทียบ กับที่ปริมาณ x = 0 แต่เมื่อปริมาณ x = 0.08 พบว่าค่าสภาพต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 6.72×10⁵ **Ω**.m (สำหรับ x = 0) เป็น 1.31×10⁶ **Ω**.m (ประมาณ 2 เท่า) ที่อุณหภูมิ 540 องศา เซลเซียส ดังแสดงในตาราง 6 ซึ่งมีความสอดคล้องเป็นอย่างดีกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของเซรามิก NaNbO₃ [54,68,75,76]

พลังงานกระตุ้น (activation energy : E_a) สามารถคำนวณค่าได้โดยใช้กฎของ Arrhenius ในการเขียนกราฟอุณหภูมิผกผัน (1000/T) เทียบกับลอการิทึมธรรมชาติของการนำไฟฟ้า (ln σ) [77,78] ดังแสดงในภาพที่ 37(ช)

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(\frac{-E_a}{k_B T}\right) \tag{4.1}$$

โดยที่ σ_0 คือค่า pre-exponential factor E_a คือค่าพลังงานกระตุ้น *T* คืออุณหภูมิในหน่วย เคลวิน และ k_B คือค่าคงที่ของโบลท์มานซ์ จากการคำนวณพลังงานกระตุ้นของเซรามิก *x*BLH (*x* = 0—0.10) โดยใช้สมการ (4.1) พบว่าที่ปริมาณ *x* = 0 มีค่า E_a คือ 0.85 eV ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ได้จาก การศึกษาก่อนหน้าของเซรามิก NaNbO₃ [79] และเมื่อปริมาณ *x* = 0.04 พบว่าค่า E_a มีค่าเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจนเป็น 1.42 eV ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเป็น 1.17 eV เมื่อ *x* = 0.08 ดังแสดงในภาพ 38(ก)—(ข) และตาราง 6 โดยจะสังเกตได้ว่าเซรามิก NaNbO₃ ที่ถูกเติมด้วย BLH จะมีค่าพลังงานกระตุ้น สูงกว่าเซรามิก NaNbO₃ ที่ไม่ถูกเติม ซึ่งค่า E_a ที่ได้อยู่ในช่วง 0.5–2 eV บ่งชี้ว่าประจุพาหะส่วนใหญ่ที่ นำไฟฟ้าในเซรามิก *x*BLH คือช่องว่างออกซิเจน (V_O) การเติม BLH ในเซรามิก NN อาจมีบทบาทใน การช่วยลดความเข้มข้นของช่องว่างของออกซิเจนและการเคลื่อนที่ของพาหะประจุไฟฟ้า (charge carrier) [80] จึงส่งผลให้ค่า *E*_a เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเซรามิก 0.04BLH จะแสดงค่า E_a สูงที่สุด แต่ค่า E_b ที่วัดได้นั้นยังคงต่ำ กว่าเซรามิก xBLH อื่นๆ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลร่วมด้วย เช่น การสูญเสียไดอิเล็กทริกที่อุณ ภูมิสูง >200 องศาเซสเซียส ที่มีค่าสูง (tan $\delta_{445^{\circ}C} \sim 0.2957$) และโครงสร้างจุลภาคที่ส่งผลเชิงลบ เช่น เกรนขนาดใหญ่ ฯลฯ ทำให้ค่า E_b ยังคงต่ำเมื่อเทียบกับเซรามิก xBLH อื่นๆ ในทางกลับกันเซรามิก 0.08BLH มีค่า E_a ปานกลาง แต่ทว่าค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่อุณภูมิสูง (>200 องศาเซสเซียส) ค่อนข้างต่ำ (tan $\delta_{445^{\circ}C} \sim 0.1451$) และโครงสร้างจุลภาคแสดงขนาดเกรนที่เล็กซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัย ส่งเสริมต่อค่า E_b จึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่า E_b ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เติม Bi(Ni_{1/2}Sn_{1/2})O₃ [81] ในระบบเซรามิก NaNbO₃



ภาพ 37 (ก)—(ค) กราฟอิมพีแดนซ์จำนวนเชิงซ้อน (Z *) และกราฟสเปกโทรสโกปิกของเซรามิก xBLH (x = 0, 0.04, และ 0.08) ที่อุณหภูมิ 460-540 องศาเซลเซียส และความถี่ 20 Hz – 10 MHz



ภาพ 38 (ก) แผนภาพ Arrhenius ของเซรามิก xBLH (x = 0, 0.04, และ 0.08) และ (ข) การ เปลี่ยนแปลงของค่า E_a เมื่อปริมาณ xBLH เพิ่มขึ้น

ตาราง 6 ค่าสภาพความต้านทาน (ρ) ณ อุณหภูมิ 460, 480, 500, 520 และ 540 องศาเซลเซียส และค่าพลังงานกระตุ้น (E_a) ของเซรามิก xBLH (x = 0—0.10)

ปริมวณ (พ.)	ρ (Ω.cm)					
ענט (X) אזו גני	460°C	480°C	500°C	520°C	540°C	a (01)
<i>x</i> = 0	2.51 ×10	3.24 ×10 ⁶	1.64 ×10 ⁶	1.06 ×10 ⁶	6.72 ×10 ⁵	0.85
<i>x</i> = 0.04	3.03 ×10 ⁶	1.80 ×10 ⁶	1.09 ×10 ⁶	5.76 ×10 ⁵	3.49 ×10 ⁵	1.42
<i>x</i> = 0.08	8.10 ×10 ⁶	6.33 ×10 ⁶	3.87 ×10 ⁶	2.46 ×10 ⁶	1.35 ×10 ⁶	1.17

บทสรุป

งานวิจัยนี้ ศึกษาผลของการเติมสารประกอบเพอรอฟสไกต์ที่มีโครงสร้างตำแหน่ง B ซับซ้อนกลุ่ม Bi(Li_{1/3}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ และ Bi(Li_{1/3}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ที่มีต่อ โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค สมบัติการกักเก็บพลังงาน สมบัติการนำไฟฟ้า และความเสถียรต่อ อุณหภูมิของเซรามิก NaNbO₃

สรุปผลการทดลองการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}+, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃

เซราม<mark>ิก (1</mark>—x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/3}⁺, Sn_{2/3}⁴⁺)O₃ ที่ปริมาณ <mark>x =</mark> 0—0.10 ถูกเตรียมโดยวิธี ้ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง โดยใช้อุณภูมิแคลไซน์ 900 อ[ิ]งศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ด้วยอัตราการ ู้ขึ้น-ลงของอุณห<mark>ภูมิ</mark> 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และอุณภูมิซินเตอร์ระ<mark>หว่</mark>าง 1<mark>3</mark>15—1250 องศา เซลเซียส เป็นเวล<mark>า 2</mark> ชั่<mark>วโมง โ</mark>ดยใช้อัตราการขึ้น-ลงของอุณหภู<mark>มิเป็น</mark> 5 <mark>อง</mark>ศาเซ<mark>ล</mark>เซียสต่อนาที พบว่า เซรามิกแสดงโครงสร้างเพอรอสไกต์ที่มีความที่บริสุทธิ์ที่ปริมาณ 0 ≤ x ≤ 0.08 และที่ปริมาณ x = 0.10 พบเฟสแปลกปลอ<mark>มปรากฏ นอกจากนี้ ที่ปริมาณ x ≥ 0.06 พ</mark>บว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างจาก ้ออร์โธรอมบิกไปเป็นโครงสร้างซู<mark>โดคิว</mark>บิก <mark>ผลการวิเคราะห์โคร</mark>งสร้างจุลภาค แสดงลักษณะเกรนที่มี ความหนาแน่น ไม่มีรูพรุน และขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงจาก 7.05 µm (x = 0.0) จนมีค่า ต่ำสุด 0.78 μm (x = 0.04) ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.03 μm และ 1.43 μm เมื่อ x เพิ่มเป็น 0.06 และ 0.08 ตามลำดับ การเพิ่มปริมาณ BLS ส่งผลให้พีค T_{P-R} เลื่อนลงไปยังอุณภูมิที่ต่ำลงและพีค ้มีลักษณะกว้างขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงพฤติกรรมความเป็นรีแลกเซอร์ใดอิเล็กทริกที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งผล ให้วงวนฮีสเทอรีซิส P—E มีลักษณะแบบบาง ซึ่งนำไปสู่คุณสมบัติการกักเก็บพลังงานที่ดีขึ้น โดยมีค่า ความหนาแน่นการกักเก็บพลังงาน (W_{rec}) และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (η) เพิ่มขึ้นตาม ปริมาณการเติม BLS ที่เพิ่มขึ้น โดยมีค่าสูงสุด ($W_{
m rec}$ = 0.56 J/cm³, η = 74 %) ภายใต้สนามไฟฟ้า 120 kV/cm ที่ปริมาณ x = 0.06 และที่ปริมาณ x = 0.06 ยังแสดงความเสถียรของอุณหภูมิในช่วง ตั้งแต่ 25–100 องศาเซลเซียส นอกจากนี้การเติม BLS ส่งผลให้ขนาดเกรนเฉลี่ยเล็กลง โดยพบขนาด เกรนเฉลี่ยที่เล็กที่สุดที่ปริมาณ x = 0.04 ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นของกระแสรั่วไหลลดลง มากสุดและค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) สูงที่สุดในทุกปริมาณการเจือ (130 kV/cm)

สรุปผลการทดลองการเตรียมเซรามิก (1-x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/2}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃

เซรามิก (1—x)NaNbO₃—xBi(Li_{1/3}⁺, Hf_{2/3}⁴⁺)O₃ เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง เริ่มจากการเตรียมผงผลึก xBLH ที่ปริมาณ x = 0—0.12 โดยใช้อุณภูมิแคลไซน์ 900 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการขึ้น-ลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และอุณภูมิซิน เตอร์ระหว่าง 1315—1250 องศาเซลเซียส โดยใช้อัตราการขึ้น-ลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียส ต่อนาที และเผาแช่ที่อุณหภูมิดัง<mark>กล่าวเ</mark>ป็นเวลา 2 ชั่วโมง พ<mark>บว่าเซรามิกแสดงโครงสร้างเพอรอสไกต์ที่</mark> ้มีความที่บริสุทธิ์ที่ปริม<mark>าณ</mark> 0 ≤ x ≤ 0.10 และที่ปริมาณ x <mark>= 0.</mark>12 พบเฟสแปลกปลอมปรากฏ นอกจากนี้ ที่ปริมาณ x ≥ 0.04 พบว่ามีการเปลี่ยนโครงสร้างจากออร์โธรอมบิกไปเป็นโครงสร้างซูโด ้ คิวบิก ผลการวิเค<mark>ราะ</mark>ห์โครงสร้างจุลภาค <mark>แสดงลักษณ</mark>ะเกรนที่มีความห<mark>นา</mark>แน่น ไม่มีรูพรุน และขนาด เกรนเฉลี่ยมีแน<mark>วโน้</mark>มลดลงจาก 7.05 μm (x = 0.0) เป็น 0.96 μm (x = 0.08) โดยมีค่าความ ้หนาแน่นสัมพัท<mark>ธ์ 9</mark>6% ในทุกตัวอย่าง เมื่อเพิ่มปริมาณ BLH พบว่าพีค 7_{P-R} เลื่อนไปยังอุณภูมิที่ต่ำ และพีคมีลักษณะ<mark>กว้างขึ้น ซึ่ง</mark>บ่งชี้ถึงพฤติกรรมความเป็นรีแล<mark>กเซอ</mark>ร์ไ<mark>ดอิเ</mark>ล็กทริกที่เพิ่มขึ้น และเมื่อ ้ปริมาณ x เพิ่<mark>มขึ้นเป็น 0.08 และ 0.10</mark> พบว่าพีคของ T_{P-R} จะเลื่อนลงไปต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง บ่งชี้ว่าที่ ่ × ≥ 0.08 ถูกเปลี่ยนเป็<mark>นเฟสรีแลกเซอร์แอนติเฟร์โรอิเล็กทริก *R* อย่า</mark>งสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล รามานสเปกโทรสโกปีที่ปริมาณ xBLH เพิ่มขึ้น เซรามิกจะถูกเปลี่ยนเป็นเฟสรีแลกเซอร์แอนติเฟร์โรอิ เล็กทริก R อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้วงวนฮีสเทอรีซิส P—E มีลักษณะแบบบาง นำไปสู่การ ปรับปรุงค่าสนามไฟฟ้าเบรกดาวน์ (E_b) ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับค่าความหนาแน่นกระแสรั่วไหลลดลง ส่งผล ให้ปรับปรุงคุณสมบัติการกักเก็บพลังงาน โดยมีค่าความหนาแน่นการกักเก็บพลังงาน (W_{rec}) สูงถึง 0.85 J/cm³ และประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงาน (η) 78% ภายใต้สนามไฟฟ้าที่ใช้ 165 kV/cm ที่ ปริมาณ x = 0.08 และเซรามิก 0.08BLH ยังแสดงความเสถียรของอุณหภูมิตั้งแต่ 25-150 องศา เซลเซียส นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้าโดยเทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปีของ เซรามิก xBLH บ่งชี้ว่าการเติม BLH ส่งผลให้เซรามิกมีโครงสร้างจุลภาคเชิงไฟฟ้าที่มีความเป็นเนื้อ เดียวกันมากขึ้น และมีค่าสภาพต้านทาน (*ρ*) ที่อุณหภูมิสูง (540 องศาเซลเซียส) เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญจาก 6.72×10⁵ Ω .m (สำหรับ x = 0) เป็น 1.31×10⁶ Ω .m (ประมาณ 2 เท่า) ที่ปริมาณ x= 0.08 ที่ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าพลังงานกระตุ้น (E_a) เพิ่มขึ้นจาก 0.85 eV (สำหรับ x = 0) เป็น 1.42 eV (x = 0.04) ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเป็น 1.17 eV (สำหรับ x = 0.08)

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเซรามิก NaNbO₃ ที่ถูกเติมด้วย BLS และ BLH สามารถ นำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับพลังงานทางเลือก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น





บรรณานุกรม

- [1] H. Jaffe, Piezoelectric ceramics, Journal of the American Ceramic Society. 41 (1958) 494–498.
- [2] D. Berlincourt, C. Cmolik, H. Jaffe, Piezoelectric properties of polycrystalline lead titanate zirconate compositions, Proceedings of the IRE. 48 (1960) 220–229.
- [3] G.H. Haertling, Ferroelectric ceramics: history and technology, Journal of the American Ceramic Society. 82 (1999) 797–818.
- [4] K.J. Puttlitz, G.T. Galyon, Impact of the ROHS directive on high-performance electronic systems, in: Lead-Free Electronic Solders, Springer, 2006: pp. 347– 365.
- [5] K. Zou, Y. Dan, H. Xu, Q. Zhang, Y. Lu, H. Huang, Y. He, Recent advances in leadfree dielectric materials for energy storage, Materials Research Bulletin. 113 (2019) 190–201.
- [6] X. Qiao, F. Zhang, D. Wu, B. Chen, X. Zhao, Z. Peng, X. Ren, P. Liang, X. Chao, Z. Yang, Superior comprehensive energy storage properties in Bi_{0.5}Na_{0.5}TiO₃-based relaxor ferroelectric ceramics, Chemical Engineering Journal. 388 (2020) 124158.
- [7] R. Shi, Y. Pu, W. Wang, X. Guo, J. Li, M. Yang, S. Zhou, A novel lead-free NaNbO₃– Bi $(Zn_{0.5}Ti_{0.5})O_3$ ceramics system for energy storage application with excellent stability, Journal of Alloys and Compounds. 815 (2020) 152356.
- [8] Y. Huang, C. Zhao, B. Wu, J. Wu, Multifunctional BaTiO₃-based relaxor ferroelectrics toward excellent energy storage performance and electrostrictive strain benefiting from crossover region, ACS Applied Materials & Interfaces. 12 (2020) 23885–23895.
- [9] M. Zhou, R. Liang, Z. Zhou, X. Dong, Superior energy storage properties and excellent stability of novel NaNbO₃-based lead-free ceramics with A-site vacancy obtained via a Bi₂O₃ substitution strategy, Journal of Materials Chemistry A. 6 (2018) 17896–17904.
- [10] L. Yang, X. Kong, F. Li, H. Hao, Z. Cheng, H. Liu, J.-F. Li, S. Zhang, Perovskite leadfree dielectrics for energy storage applications, Progress in Materials Science. 102 (2019) 72–108.

- [11] B. Luo, X. Wang, E. Tian, H. Song, H. Wang, L. Li, Enhanced energy-storage density and high efficiency of lead-free CaTiO₃–BiScO₃ linear dielectric ceramics, ACS Applied Materials & Interfaces. 9 (2017) 19963–19972.
- [12] B. Chu, X. Zhou, K. Ren, B. Neese, M. Lin, Q. Wang, F. Bauer, Qm. Zhang, A dielectric polymer with high electric energy density and fast discharge speed, Science. 313 (2006) 334–336.
- [13] X. Hao, A review on the dielectric materials for high energy-storage application, Journal of Advanced Dielectrics. 3 (2013) 1330001.
- [14] X. Liu, Y. Li, X. Hao, Ultra-high energy-storage density and fast discharge speed of (Pb0.98-xLa_{0.02}Sr_x)(Zr_{0.9}Sn_{0.1})0.995O₃ antiferroelectric ceramics prepared via the tape-casting method, Journal of Materials Chemistry A. 7 (2019) 11858– 11866.
- [15] P. Gao, Z. Liu, N. Zhang, H. Wu, A.A. Bokov, W. Ren, Z.-G. Ye, New antiferroelectric perovskite system with ultrahigh energy-storage performance at low electric field, Chemistry of Materials. 31 (2019) 979–990.
- [16] I. Reaney, J. Petzelt, V. Voitsekhovskii, F. Chu, N. Setter, B-site order and infrared reflectivity in A(B'B')O₃ complex perovskite ceramics, Journal of Applied Physics. 76 (1994) 2086–2092.
- [17] J. Ye, G. Wang, M. Zhou, N. Liu, X. Chen, S. Li, F. Cao, X. Dong, Excellent comprehensive energy storage properties of novel lead-free NaNbO₃-based ceramics for dielectric capacitor applications, Journal of Materials Chemistry C. 7 (2019) 5639–5645.
- [18] J. Shi, X. Chen, C. Sun, F. Pang, H. Chen, X. Dong, X. Zhou, K. Wang, H. Zhou, Superior thermal and frequency stability and decent fatigue endurance of high energy storage properties in NaNbO3-based lead-free ceramics, Ceramics International. 46 (2020) 25731–25737.
- [19] R. Kötz, M. Carlen, Principles and applications of electrochemical capacitors, Electrochimica Acta. 45 (2000) 2483–2498.
- [20] M. Winter, R.J. Brodd, What are batteries, fuel cells, and supercapacitors?, Chemical Reviews. 104 (2004) 4245–4270.

- [21] G. Wang, Z. Lu, Y. Li, L. Li, H. Ji, A. Feteira, D. Zhou, D. Wang, S. Zhang, I.M. Reaney, Electroceramics for high-energy density capacitors: current status and future perspectives, Chemical Reviews. 121 (2021) 6124–6172.
- [22] T. Shao, H. Du, H. Ma, S. Qu, J. Wang, J. Wang, X. Wei, Z. Xu, Potassium-sodium niobate based lead-free ceramics: novel electrical energy storage materials, Journal of Materials Chemistry A. 5 (2017) 554–563.
- [23] H. Palneedi, M. Peddigari, A. Upadhyay, J.P. Silva, G.-T. Hwang, J. Ryu, Leadbased and lead-free ferroelectric ceramic capacitors for electrical energy storage, in: Ferroelectric Materials for Energy Harvesting and Storage, Elsevier, 2021: pp. 279–356.
- [24] น. วิทยากร, วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์., 2556.
- [25] Y. Long, A-site ordered quadruple perovskite oxides, Chinese Physics B. 25 (2016) 078108.
- [26] P. Davies, H. Wu, A. Borisevich, I. Molodetsky, L. Farber, Crystal chemistry of complex perovskites: new cation-ordered dielectric oxides, Annu. Rev. Mater. Res. 38 (2008) 369–401.
- [27] J. Herbert, Ceramic dielectrics and capacitors, CRC Press, 1985.
- [28] Z. Liu, J. Hu, H. Yang, H. Mao, R. Hemley, High-pressure synchrotron X-ray diffraction and infrared microspectroscopy: applications to dense hydrous phases, Journal of Physics: Condensed Matter. 14 (2002) 10641.
- [29] A.B. Spierings, M. u Schneider, R. Eggenberger, Comparison of density measurement techniques for additive manufactured metallic parts, Rapid Prototyping Journal. 17 (2011) 380–386.
- [30] H. Seiler, Secondary electron emission in the scanning electron microscope, Journal of Applied Physics. 54 (1983) R1–R18.
- [31] C. Kornphom, The Study of Local Atomic Structure and Phase Transition with Effecting on Piezoelectric Property of (1-x)BNT-xBCST Ceramics by Using Synchrotron and Raman Spectroscopy Technique, Burapha Science Journal. (2022) 261–273.
- [32] Y. Ozaki, S. Šašic, Introduction to Raman spectroscopy, Pharmaceutical Applications of Raman Spectroscopy. (2008) 1–28.

- [33] Z. Li, M.J. Deen, S. Kumar, P.R. Selvaganapathy, Raman spectroscopy for in-line water quality monitoring—Instrumentation and potential, Sensors. 14 (2014) 17275–17303.
- [34] J.R. Macdonald, Impedance spectroscopy, Annals of Biomedical Engineering. 20 (1992) 289–305.
- [35] D. Czekaj, A. Lisińska-Czekaj, B. Garbarz-Glos, W. Bąk, Modelling of dielectric properties of BiNbO4-based microwave ceramics, Archives of Metallurgy and Materials. 65 (2020) 1177–1181.
- [36] A.R. West, Solid state chemistry and its applications, John Wiley & Sons, 2022.
- [37] S.R. James, Introduction to the principles of ceramic processing, John Willey and Sons Inc, New York. (1988).
- [38] J. Halloran, Calcination, ASM International, Engineered Materials Handbook. 4 (1991) 109–114.
- [39] M.N. Rahaman, Ceramic processing and sintering, CRC press, 2017.
- [40] L.-M. Wang, Q.-X. Liu, D. Zhou, Dielectric and energy storage properties of the (1-x)BaTiO₃-xBi(Li_{1/3}Hf_{2/3})O₃ (0.08≤×≤0.14) ceramics, Materials Letters. 283 (2021) 128823.
- [41] J. Ma, Y. Lin, H. Yang, J. Tian, Achieved high energy storage property and power density in NaNbO₃-Bi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ ceramics, Journal of Alloys and Compounds. 868 (2021) 159206.
- [42] F. Si, B. Tang, Z. Fang, H. Li, S. Zhang, Enhanced energy storage and fast chargedischarge properties of (1-x)BaTiO₃-xBi(Ni_{1/2}Sn_{1/2})O₃ relaxor ferroelectric ceramics, Ceramics International. 45 (2019) 17580–17590.
- [43] F. Pang, X. Chen, C. Sun, J. Shi, X. Li, H. Chen, X. Dong, H. Zhou, Ultrahigh energy storage characteristics of sodium niobate-based ceramics by introducing a local random field, ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 8 (2020) 14985–14995.
- [44] W.-B. Li, D. Zhou, R. Xu, L.-X. Pang, I.M. Reaney, BaTiO₃-Bi(Li_{0.5}Ta_{0.5})O₃, lead-free ceramics, and multilayers with high energy storage density and efficiency, ACS Applied Energy Materials. 1 (2018) 5016–5023.
- [45] F. Pang, X. Chen, J. Shi, C. Sun, H. Chen, X. Dong, H. Zhou, Bi (Mg_{0.5}Sn_{0.5})O₃-Doped NaNbO3 lead-free ceramics achieve excellent energy-storage and

charge/discharge performances, ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 9 (2021) 4863–4871.

- [46] N. Qu, H. Du, X. Hao, A new strategy to realize high comprehensive energy storage properties in lead-free bulk ceramics, Journal of Materials Chemistry C. 7 (2019) 7993–8002.
- [47] Z. Song, H. Liu, S. Zhang, Z. Wang, Y. Shi, H. Hao, M. Cao, Z. Yao, Z. Yu, Effect of grain size on the energy storage properties of (Ba_{0.4}Sr_{0.6})TiO₃ paraelectric ceramics, Journal of the European Ceramic Society. 34 (2014) 1209–1217.
- [48] G. Shirane, R. Newnham, R. Pepinsky, Dielectric Properties and Phase Transitions of NaNbO₃ and (Na, K)NbO₃, Physical Review. 96 (1954) 581.
- [49] L. Chao, Y. Hou, M. Zheng, M. Zhu, High dense structure boosts stability of antiferroelectric phase of NaNbO₃ polycrystalline ceramics, Applied Physics Letters. 108 (2016) 212902.
- [50] H.D. Megaw, The seven phases of sodium niobate, Ferroelectrics. 7 (1974) 87– 89.
- [51] X. Dong, X. Li, X. Chen, H. Chen, C. Sun, J. Shi, F. Pang, H. Zhou, High energy storage and ultrafast discharge in NaNbO₃-based lead-free dielectric capacitors via a relaxor strategy, Ceramics International. 47 (2021) 3079–3088.
- [52] H. Qi, R. Zuo, A. Xie, A. Tian, J. Fu, Y. Zhang, S. Zhang, Ultrahigh energy-storage density in NaNbO₃-based lead-free relaxor antiferroelectric ceramics with nanoscale domains, Advanced Functional Materials. 29 (2019) 1903877.
- [53] P. Fan, S.-T. Zhang, J. Xu, J. Zang, C. Samart, T. Zhang, H. Tan, D. Salamon, H. Zhang, G. Liu, Relaxor/antiferroelectric composites: a solution to achieve high energy storage performance in lead-free dielectric ceramics, Journal of Materials Chemistry C. 8 (2020) 5681–5691.
- [54] A. Tian, R. Zuo, H. Qi, M. Shi, Large energy-storage density in transition-metal oxide modified NaNbO₃-Bi(Mg_{0.5}Ti_{0.5})O₃ lead-free ceramics through regulating the antiferroelectric phase structure, Journal of Materials Chemistry A. 8 (2020) 8352–8359.

- [55] J. Ye, G. Wang, X. Chen, X. Dong, Effect of rare-earth doping on the dielectric property and polarization behavior of antiferroelectric sodium niobate-based ceramics, Journal of Materiomics. 7 (2021) 339–346.
- [56] Q. Hu, Y. Tian, Q. Zhu, J. Bian, L. Jin, H. Du, D. Alikin, V.Y. Shur, Y. Feng, Z. Xu, Achieve ultrahigh energy storage performance in BaTiO₃–Bi(Mg_{1/2}Ti_{1/2}) O₃ relaxor ferroelectric ceramics via nano-scale polarization mismatch and reconstruction, Nano Energy. 67 (2020) 104264.
- [57] X. Dong, X. Li, X. Chen, H. Chen, C. Sun, J. Shi, F. Pang, H. Zhou, High energy storage density and power density achieved simultaneously in NaNbO₃-based lead-free ceramics via antiferroelectricity enhancement, Journal of Materiomics. 7 (2021) 629–639.
- [58] R.D. Shannon, Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides, Acta Crystallographica Section A: Crystal Physics, Diffraction, Theoretical and General Crystallography. 32 (1976) 751–767.
- [59] Z. Yang, F. Gao, H. Du, L. Jin, L. Yan, Q. Hu, Y. Yu, S. Qu, X. Wei, Z. Xu, Grain size engineered lead-free ceramics with both large energy storage density and ultrahigh mechanical properties, Nano Energy. 58 (2019) 768–777.
- [60] H. Qi, R. Zuo, A. Xie, J. Fu, D. Zhang, Excellent energy-storage properties of NaNbO3-based lead-free antiferroelectric orthorhombic P-phase (*Pbma*) ceramics with repeatable double polarization-field loops, Journal of the European Ceramic Society. 39 (2019) 3703–3709.
- [61] S. Li, P. Shi, X. Zhu, B. Yang, X. Zhang, R. Kang, Q. Liu, Y. Gao, H. Sun, X. Lou, Enhanced energy storage properties in lead-free NaNbO₃-Sr_{0.7}Bi_{0.2}TiO₃-BaSnO₃ ternary ceramic, Journal of Materials Science. 56 (2021) 11922–11931.
- [62] Z.-G. Liu, M.-D. Li, Z.-H. Tang, X.-G. Tang, Enhanced energy storage density and efficiency in lead-free Bi(Mg_{1/2}Hf_{1/2})O₃-modified BaTiO₃ ceramics, Chemical Engineering Journal. 418 (2021) 129379.
- [63] T. Wei, K. Liu, P. Fan, D. Lu, B. Ye, C. Zhou, H. Yang, H. Tan, D. Salamon, B. Nan, Novel NaNbO₃–Sr_{0.7}Bi_{0.2}TiO₃ lead-free dielectric ceramics with excellent energy storage properties, Ceramics International. 47 (2021) 3713–3719.

- [64] X. Cheng, X. Chen, P. Fan, Excellent energy storage performance in NaNbO₃based relaxor antiferroeic ceramics under a low electric field, Journal of Electroceramics. (2022) 1–9.
- [65] J. Wang, L. Zhu, Y. Jin, X. Peng, F. Peng, L. Jiang, Y. Yao, W. Liu, Effective strategy to optimize energy storage properties in lead-free (Ba_{0.3}Sr_{0.7})TiO₃ ceramics by the suppression of leakage current, Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 32 (2021) 10726–10733.
- [66] Y. Pu, L. Zhang, M. Chen, T. Wei, X. Peng, Novel Na_{0.5}Bi_{0.5}Ti_{0.5}O₃ based, lead-free energy storage ceramics with high power and energy density and excellent high temperature stability, Chem. Eng. J. 383 (2020) 123154.
- [67] X. Chen, X. Li, J. Sun, C. Sun, J. Shi, F. Pang, H. Zhou, Simultaneously achieving ultrahigh energy storage density and energy efficiency in barium titanate based ceramics, Ceramics International. 46 (2020) 2764–2771.
- [68] S. Zhang, W. Li, Y. Zhang, X. Tang, Y. Jiang, X. Guo, Large energy density and high efficiency achieved simultaneously in Bi (Mg_{0.5}Hf_{0.5})O₃-modified NaNbO₃ ceramics, Results in Physics. 44 (2023) 106194.
- [69] J. Shi, X. Chen, X. Li, J. Sun, C. Sun, F. Pang, H. Zhou, Realizing ultrahigh recoverable energy density and superior charge–discharge performance in NaNbO₃-based lead-free ceramics via a local random field strategy, Journal of Materials Chemistry C. 8 (2020) 3784–3794.
- [70] S. Lanfredi, M. Lente, J. Eiras, Phase transition at low temperature in NaNbO₃ ceramic, Applied Physics Letters. 80 (2002) 2731–2733.
- [71] J. Wang, H. Fan, M. Wang, P. Fan, Significantly enhanced energy storage performance in Sm-doped 0.88NaNbO₃-0.12Sr_{0.7}Bi_{0.2}TiO₃ lead-free ceramics, Ceramics International. 47 (2021) 17964–17970.
- [72] J. Ma, Y. Lin, H. Yang, J. Tian, Achieved high energy storage property and power density in NaNbO₃-Bi(Sn_{0.5}Ni_{0.5})O₃ ceramics, Journal of Alloys and Compounds. 868 (2021) 159206.
- [73] J. Shi, X. Chen, X. Li, J. Sun, C. Sun, F. Pang, H. Zhou, Realizing ultrahigh recoverable energy density and superior charge-discharge performance in

NaNbO₃-based lead-free ceramics via a local random field strategy, Journal of Materials Chemistry C. 8 (2020) 3784-3794.

- [74] M. Rawat, K. Yadav, Compositional effects on structural, dielectric, ferroelectric and transport properties of $Ba1-x(Bi_{0.5}Li_{0.5})xTiO_3$ ceramics, Materials Chemistry and Physics. 148 (2014) 655–663.
- [75] X. Dong, X. Li, X. Chen, H. Chen, C. Sun, J. Shi, F. Pang, H. Zhou, High energy storage density and power density achieved simultaneously in NaNbO₃-based lead-free ceramics via antiferroelectricity enhancement, Journal of Materiomics. 7 (2021) 629–639.
- [76] Z. Liu, J. Lu, Y. Mao, P. Ren, H. Fan, Energy storage properties of NaNbO₃-CaZrO₃ ceramics with coexistence of ferroelectric and antiferroelectric phases, Journal of the European Ceramic Society. 38 (2018) 4939–4945.
- [77] L. Wu, X. Wang, L. Li, Lead-free BaTiO₃-Bi(Zn_{2/3}Nb_{1/3})O₃ weakly coupled relaxor ferroelectric materials for energy storage, RSC Advances. 6 (2016) 14273–14282.
- [78] J. Bian, M. Otonicar, M. Spreitzer, D. Vengust, D. Suvorov, Structural evolution, dielectric and energy storage properties of $Na(Nb_{1-x}Ta_x)O_3$ ceramics prepared by spark plasma sintering, Journal of the European Ceramic Society. 39 (2019) 2339–2347.
- [79] F. Ye, X. Jiang, X. Huang, R. Zeng, C. Chen, X. Nie, H. Cheng, The effect of B-site acceptor doping on the microstructure and electric properties of NaNbO₃ ceramics, Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 33 (2022) 4497–4509.
- [80] R.A. Malik, A. Hussain, A. Maqbool, A. Zaman, T.K. Song, W.-J. Kim, M.-H. Kim, Giant strain, thermally-stable high energy storage properties and structural evolution of Bi-based lead-free piezoceramics, Journal of Alloys and Compounds. 682 (2016) 302–310.
- [81] Z. Yang, H. Du, L. Jin, Q. Hu, H. Wang, Y. Li, J. Wang, F. Gao, S. Qu, Realizing high comprehensive energy storage performance in lead-free bulk ceramics via designing an unmatched temperature range, Journal of Materials Chemistry A. 7 (2019) 27256–27266.